

FLUORESCENT SUBSTANCE, FLUORESCENT SUBSTANCE COMPOSITION, LATENT MAGE-FORMING MEMBER AND OPTICALLY **READING DEVICE**

Patent Number: JP8151545

Publication date: 1996-06-11

Inventor(s):

OSHIMA TOSHIO; NABESHIMA TOMIO; KAMOTO TAKANORI; YAMADA YUKINORI;

KODERA YUJI

Applicant(s)::

HITACHI MAXELL LTD

Requested

Patent:

□ JP8151545

Application

Number:

JP19950061537 19950227

Priority Number

(s):

IPC

C09D11/00; C09D11/02; C09K11/08; C09K11/62; C09K11/62; C09K11/64;

C09K11/78; C09K11/78; C09K11/80; C09K11/80; C09K11/81; G11B7/00

EC

Classification: Equivalents:

Classification:

Abstract

PURPOSE: To provide the fluorescent substance emitting light having a different wavelength from that of an irradiated excitation light, having an average ultrafine particle size, large in emission output, high in reliability excellent in durability, etc., and useful for optically reading devices, etc.

CONSTITUTION: This fluorescent substance emits light having a different wavelength from that of irradiated excitation light and has an average particle size which is a smaller ultrafine particulate size than the maximum strength wavelength of fluorescent light emitted from the fluorescent substance or a smaller ultrafine particlate size than the maximum strength wavelength of the excitation light, preferably <0.8&mu m. The fluorescent substance preferably comprises an oxygen-containing acid salt compound having a formula: Lnx A1-x PO4 (Ln is at least one kind element selected from Nd, Yb and Er; A is at least one kind element selected from Y, La, Gd, Bi, Ce, Lu, In, and Tb; x is a number of 0.01-0.99), etc. The fluorescent substance composition comprises the fluorescent substance, a solvent and a binder permitting the penetration of the excitation light and the fluorescent light.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-151545

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

(51) Int.CL.		酸別記号	庁内整理番号	F	I		技術表示箇所
C09D	11/00	PSZ					
	11/02	PTE					
C09K	11/08	В	9280-4H				
	11/62	CPJ					
		CPN					
			-	_L	70 Page - 17 4 4 5	 	

審査請求 未請求 請求項の数119 FD (全 68 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特顯平7-61537	(71)出顧人	000005810 日立マクセル株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)2月27日		大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号
		(72)発明者	大鳴 敏夫
(31)優先権主張番号	特顧平6-172716		大阪府淡木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
(32)優先日	平 6 (1994) 7 月25日		クセル株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	鍋嶌 富雄
(31) 優先権主張番号	特顯平6-199657		大阪府淡木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
(32) 優先日	平 6 (1994) 8 月24日		クセル株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	加本 貴則
(31)優先権主張番号	特顏平6-246986		大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ
(32) 優先日	平 6 (1994) 9 月14日		クセル株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	弁理士 武 顯次郎
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 蛍光体、蛍光体組成物、潜像形成部材ならびに光学読取装置

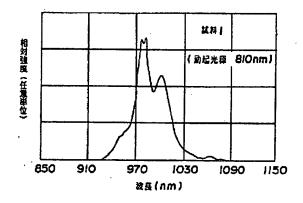
(57)【要約】

【目的】 新規な蛍光体を提供する。

【構成】 一般式

Lnx A1-x PO4

式中LnはNd、Yb、Erのグループから選択された 少なくとも1種の元素、AはY, La, Gd, Bi, C e, Lu, In, Tbのグループから選択された少なく とも1種の元素、Xは0.01~0.99の範囲の数 值。



【特許請求の範囲】

ls.

【請求項1】 照射した励起光に対し、異なる波長の光を発する蛍光体において、その蛍光体の平均粒子サイズが該蛍光体から発する蛍光の最高強度波長より小さい極微粒子状であることを特徴とする蛍光体。

【請求項2】 照射した励起光に対し、異なる波長の光を発する蛍光体において、その蛍光体の平均粒子サイズが前記励起光の最高強度波長より小さい極微粒子状であることを特徴とする蛍光体。

【請求項3】 請求項1または2記載において、前記蛍 10 光体の平均粒子サイズが0.8μm未満であることを特 徴とする蛍光体。

【請求項4】 請求項1ないし3記載のいずれかにおいて、前記蛍光体が光学活性元素として少なくともNdを含む有機金属化合物であることを特徴とする蛍光体。

【請求項5】 請求項4記載において、前記有機金属化合物中の有機物がカルボン酸類、ケトン類、エーテル類、アミン類のグループから選択された少なくとも1種の有機物であることを特徴とする蛍光体。

【請求項6】 請求項4記載において、前記有機金属化 20 合物が桂皮酸ネオジム、桂皮酸ネオジム・イッテルビウム複合塩、安息酸ネオジム・イッテルビウム複合塩、ナフトエ酸ネオジム、ナフトエ酸ネオジム・イッテルビウム複合塩のグループから選択された少なくとも1種の有機物であることを特徴とする蛍光体。

【請求項7】 請求項4記載において、前記蛍光体がNdとYbを含み、NdとYbの含有モル分率が9:1~5:5の範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体。

【請求項8】 光学活性元素としてNd, Yb, Erの 30 いずれか1種以上の元素を含む含酸素酸塩化合物からなることを特徴とする蛍光体。

【請求項9】 請求項8記載において、前記含酸素酸塩 化合物がリン酸塩化合物であることを特徴とする蛍光 体

【請求項10】 請求項9記載において、前記リン酸塩 化合物が下記の一般式(1)を有する化合物であること を特徴とする蛍光体。

一般式(1)

Lnx A1-x PO4

式中LnはNd, Yb, Erのグループから選択された 少なくとも1種の元素、

AはY, La, Gd, Bi, Ce, Lu, In, Tbの グループから選択された少なくとも1種の元素、

Xは0.01~0.99の範囲の数値。

【請求項11】 請求項9記載において、前記リン酸塩 化合物が下記の一般式(2)を有する化合物であること を特徴とする蛍光体。

一般式(2)

DE1-x Lnx Py Oz

式中DはLi, Na, K, Rb, Csのグループから選択された少なくとも1種の元素、

EはY, La, Gd, Bi, Ce, Lu, In, Tbの グループから選択された少なくとも1種の元素、

LnはNd, Yb, Erのグループから選択された少な くとも1種の元素、

Xは0.01~0.99の範囲の数値、

Yは1~5の範囲の数値、

Zは4~14の範囲の数値。

【請求項12】 光学活性元素としてFeとErを有し、その光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択された少なくとも1種の元素を含有していることを特徴とする蛍光体。

【請求項13】 請求項12記載において、前記蛍光体が下記の一般式(3)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(3)

G3 J5 O12

O 式中GはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Erからな り

JはSc, Ga, Al, Inのグループから選択された 少なくとも1種の元素と、Feからなる。

【請求項14】 請求項12記載において、前記蛍光体が下記の一般式(4)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式 (4)

GJO₃

O 式中GはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Erからな り

JはSc, Ga, Al, Inのグループから選択された 少なくとも1種の元素と、Feからなる。

【請求項15】 請求項12記載において、前記蛍光体が下記の一般式(5)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(5)

G2 J4 O12

40 式中GはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Erからな り

【請求項16】 光学活性元素としてYbを有し、その 光学活性元素の他にSc、Ga、Al、In、Y、B i、Ce、Gd、Lu、Laのグループから選択された 少なくとも1種の元素を含有していることを特徴とする 蛍光体。

50 【請求項17】 請求項16記載において、前記蛍光体

が下記の一般式(6)を有する化合物であることを特徴 とする蛍光体。

一般式(6)

L3 M5 O12

式中LはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択された少なくとも1種の元素と、Ybからなり、

MはSc, Ga, Al, Inのグループから選択された 少なくとも1種の元素からなる。

【請求項18】 請求項16記載において、前記蛍光体 10 が下記の一般式(7)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(7)

LMO₃

式中LはY、Bi、Ce、Gd、Lu、Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Ybからな り、

MはSc, Ga, Al, Inのグループから選択された 少なくとも1種の元素からなる。

【請求項19】 請求項16記載において、前記蛍光体 20 が下記の一般式(8)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(8)

L2 M4 O12

式中LはY,Bi,Ce,Gd,Lu,Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Ybからな り、

MはSc, Ga, Al, Inのグループから選択された 少なくとも1種の元素からなる。

【請求項20】 請求項16記載において、前記蛍光体 30 がYbx Y1-x Als O12からなり、式中のXの値が 0.05~0.7の範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体。

【請求項21】 請求項1ないし20のいずれかの記載において、前記励起を開始してから発光強度が最高発光強度の90%に到達するまでの立ち上がり時間が200 μ sec以内であることを特徴とする蛍光体。

【請求項22】 請求項1ないし21のいずれかの記載 において、前記励起光の照射を停止して残光の発光強度 が最高発光強度の80%減衰するまでの時間が200μ 40 sec以内であることを特徴とする蛍光体。

【請求項23】 赤外線に対して吸収特性を有する有機物を担持させたNb, Yb、Erのグループから選択された1種以上の希土類含有有機物からなることを特徴とする蛍光体。

【請求項24】 請求項23記載において、波長が700~1000nmの範囲の光に対して吸収特性を有する有機物を担持させたNb、Yb、Erのグループから選択された1種以上の希土類含有芳香族カルボン酸塩からなることを特徴とする蛍光体。

4

【請求項25】 請求項23記載において、前記有機物がポリメチン系、アントラキノン系、ジチオール金属系、フタロシアニン系、インドフェノール系、アゾ系色素のグループから選択された1種以上の有機物を担持させたことを特徴とする蛍光体。

【請求項26】 光学活性元素として少なくともNbまたはYbを有し、その光学活性元素の他にMoまたはWの少なくとも1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを含有していることを特徴とする蛍光体。

【請求項27】 請求項26記載において、前記蛍光体 の平均粒子サイズが1μm以下であることを特徴とする 蛍光体。

【請求項28】 請求項26記載において、励起光の照射を停止して残光の発光強度が最高発光強度の10%になるまでの時間が500μsec以内であり、1msec周期以下のパルス光励起で発光を識別するシステムに用いられることを特徴とする蛍光体。

【請求項29】 請求項26記載において、励起光の照射を停止して残光の発光強度が最高発光強度の10%になるまでの時間が500μsec以内であり、0.5m/sec以上の走行下で発光を識別するシステムに用いられることを特徴とする蛍光体。

【請求項30】 請求項26記載において、水に500 時間没漬した後に取り出して乾燥したときの回収率が9 5重量%以上であることを特徴とする蛍光体。

【請求項31】 請求項26記載において、Moまたは Wの少なくとも1種の酸化物に対する光学活性元素の原 子比率sが、O<s≦2であることを特徴とする蛍光 体

【請求項32】 請求項26記載において、Moまたは Wの少なくとも1種の酸化物に対するアルカリ土類金属 の原子比率もが、O<t≤3であることを特徴とする蛍 光体。

【請求項33】 請求項26記載において、前記蛍光体が下記の一般式(9)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(9)

(Ndi-x Ybx) y Qz (RO4)

式中QはCa、Mg、Sr、Baのグループから選択された少なくとも1種の元素、

RはMo, Wのグループから選択された少なくとも1種の元素、

Xは0~1の範囲の数値、

Yは0を超え1未満の数値、

2は0を超え1以下の数値。

【請求項34】 請求項26記載において、前記蛍光体が下記の一般式(10)を有する化合物であることを特徴とする蛍光体。

一般式(10)

50 (Nd1-π Ybπ) 21 Q8-31 (RO4) 8

式中QはCa, Mg, Sr, Baのグループから選択された少なくとも1種の元素、

RはMo, Wのグループから選択された少なくとも1種の元素、

Xは0~1の範囲の数値、

Yは0を超え8/3の範囲の数値。

【請求項35】 請求項26記載において、前記一般式 (10)中のXが0.02~0.6の範囲の数値で、かつYが1/3~5/3の範囲の数値であることを特徴とする蛍光体。

【請求項36】 請求項26記載において、前記アルカリ土類金属がCaであることを特徴とする蛍光体。

【請求項37】 T2 RO4 · nH2 O (ただし式中T はLi, Na, Kのグループから選択された少なくとも 1種の元素、RはMo, Wのグループから選択された少なくとも1種の元素、nはO以上の数値)で示される塩を含むフラックス材料に、NdまたはYbの少なくとも 1種の光学活性元素と、MoまたはWの少なくとも1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを入れて焼成した後、 前記フラックス材料を溶剤で溶解して除去することを特 20 物。 做とする蛍光体の製造方法。

【請求項38】 請求項37記載において、前記フラックス材料のTがNaであることを特徴とする蛍光体の製造方法。

【請求項39】 請求項37記載において、前記フラックス材料のRがMoであることを特徴とする蛍光体の製造方法

【請求項40】 請求項37記載において、前記フラックス材料の蛍光体材料に対する混合モル比を1~10の 範囲に規制したことを特徴とする蛍光体の製造方法。

【請求項41】 照射した励起光に対して異なる波長の 蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記蛍光の最高 強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体と

前記励起光ならびに蛍光に対して透過性を有するバインダと

溶剤とを含有したことを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項42】 照射した励起光に対して異なる波長の 蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記励起光の最 高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体と、

前記励起光ならびに蛍光に対して透過性を有するパイン 40 ダと、

溶剤とを含有したことを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項43】 請求項41または42記載において、 前記蛍光体組成物がインクジェットプリンタ用インクで あることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項44】 請求項41ないし43のいずれかの記 載において、前記蛍光体が有機金属化合物から構成され ていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項45】 請求項44記載において、前記有機金 属化合物中の有機物がカルボン酸類、ケトン類、エーテ 50 ル類、アミン類のグループから選択された少なくとも1 種の有機物であることを特徴とする蛍光体組成物。

6

【請求項46】 請求項44記載において、前記有機金属化合物が桂皮酸ネオジム、桂皮酸ネオジム・イッテルビウム複合塩、安息酸ネオジム・イッテルビウム複合塩、ナフト工酸ネオジム、ナフト工酸ネオジム・イッテルビウム複合塩のグループから選択された少なくとも1種の有機物であることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項47】 請求項44記載において、前記蛍光体10 がNdとYbを含み、NdとYbの含有モル分率が9: 1~5:5の範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項48】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記蛍光体の密度 ρ 1と前記バインダの密度 ρ 2とが、 ρ 1/ ρ 2 \leq 1.8の関係にあることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項49】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記蛍光体組成物の粘度が2~25cpsの範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項50】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記蛍光体組成物の表面張力が23~40 dyne/cmの範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項51】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記蛍光体組成物の比抵抗が2000Ωcm以下の範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項52】 請求項41ないし47のいずれかの記 30 載において、前記蛍光体組成物のpHが4.5~10の 範囲に規制されていることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項53】 請求項40ないし47のいずれかの記載において、前記バインダが水溶性樹脂であることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項54】 請求項53記載において、前記溶剤が 水ならびに水と相溶性のある易揮発性液体であることを 特徴とする蛍光体組成物。

【請求項55】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記バインダの前記励起光ならびに蛍光に対する光透過率が80%以上であることを特徴とする蛍光体組成物。

【請求項56】 請求項41ないし47のいずれかの記 載において、前記バインダが非水溶性樹脂であることを 特徴とする蛍光体組成物。

【請求項57】 請求項41ないし47のいずれかの記載において、前記蛍光体が励起を開始してから発光強度が最高発光強度の90%に到達するまでの立ち上がり時間が200μsec以内であることを特徴とする蛍光体組成物。

) 【請求項58】 請求項41ないし47ならびに57の

いずれかの記載において、前記励起光の照射を停止して 残光の発光強度が最高発光強度の80%減衰するまでの 時間が200µsec以内の蛍光体を用いたことを特徴 とする蛍光体組成物。

【請求項59】 請求項41ないし47のいずれかの記 載において、染料を添加したことを特徴とする蛍光体組 成物。

【請求項60】 赤外線に対して吸収特性を有する有機 物を担持させたNb、Yb、Erのグループから選択さ 機バインダーとを含有することを特徴とする蛍光体組成

【請求項61】 光学活性元素として少なくともNbま たはYbを有し、その光学活性元素の他にMoまたはW の少なくとも1種の酸化物とアルカリ土類金属とを含有 した蛍光体と、有機バインダーとを含有することを特徴 とする蛍光体組成物。

【請求項62】 光学活性元素として少なくともNbま たはYbを有し、その光学活性元素の他にMoまたはW の少なくとも1種の酸化物とアルカリ土類金属とを含有 20 した蛍光体を有機バインダーに分散、保持させた蛍光体 組成物を、テープ状基材に塗布したことを特徴とするイ ンクリボン、

【請求項63】 照射した励起光に対して異なる波長の 蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記蛍光の最高 強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体を含む潜像印刷 層を有していることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項64】 照射した励起光に対して異なる波長の 蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記励起光の最 高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体を含む潜像印 30 刷層を有していることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項65】 請求項63または64記載において、 前記潜像印刷層がインクジェットプリントによって形成 された印刷層であることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項66】 請求項63ないし65のいずれかの記 載において、前記蛍光体が有機金属化合物から構成され ていることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項67】 請求項66記載において、前記有機金 属化合物中の有機物がカルボン酸類、ケトン類、エーテ ル類、アミン類のグループから選択された少なくとも1 40 種の有機物であることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項68】 請求項67記載において、前記有機金 属化合物が桂皮酸ネオジム、桂皮酸ネオジム・イッテル ビウム複合塩、安息酸ネオジム・イッテルビウム複合 塩、ナフトエ酸ネオジム、ナフトエ酸ネオジム・イッテ ルビウム複合塩のグループから選択された少なくとも1 種の有機物であることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項69】 請求項66記載において、前記蛍光体 がNdとYbを含み、NdとYbの含有モル分率が9: 1~5:5の範囲に規制されていることを特徴とする潜 50 ることを特徴とする潜像形成部材。

像形成部材。

【請求項70】 請求項63または64記載において、 前記蛍光体がNd, Yb, Erのいずれか1種以上の元 素を含む含酸素酸塩化合物からなる蛍光体であることを 特徴とする潜像形成部材。

8

【請求項71】 請求項63または64記載において、 前記蛍光体が光学活性元素としてFeとErを有し、そ の光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, B i, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択された れた1種以上の希土類含有有機物からなる蛍光体と、有 10 少なくとも1種の元素を含有していることを特徴とする 潜像形成部材。

> 【請求項72】 請求項63または64記載において、 前記蛍光体が光学活性元素としてYbを有し、その光学 活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, C e、Gd、Lu、Laのグループから選択された少なく とも1種の元素を含有していることを特徴とする潜像形 成部材。

【請求項73】 照射した励起光に対して異なる波長の 光を発する蛍光体粒子を含有した潜像印刷層を有する潜 像形成部材において、前記印刷層中の蛍光体粒子の含有 率が1重量%を超えて30重量%未満であることを特徴 とする潜像形成部材。

【請求項74】 請求項63または64記載において、 前記潜像印刷層が5重量%以上のバインダを含有してい ることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項75】 照射した励起光に対して異なる波長の 光を発する蛍光体粒子を含有した潜像印刷層を有する潜 像形成部材において、前記印刷層の厚さが前記蛍光体粒 子の粒子サイズの35倍以内であることを特徴とする潜 像形成部材。

【請求項76】 照射した励起光に対して異なる波長の 光を発する蛍光体粒子とバインダとを含有した潜像印刷 層を有する潜像形成部材において、前記バインダの励起 光ならびに蛍光に対する光透過率が80%以上であるこ とを特徴とする潜像形成部材。

【請求項77】 照射した励起光に対して異なる波長の 光を発する蛍光体粒子が繊維の集合体上に付着している ことを特徴とする潜像形成部材。

【請求項78】 請求項77記載において、前記蛍光体 粒子の平均粒子サイズが前記繊維の径よりも小さいこと を特徴とする潜像形成部材。

【請求項79】 請求項77記載において、前記繊維の 集合体が紙であることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項80】 照射した励起光に対して異なる波長の 蛍光を発する蛍光体を含む潜像印刷層の可視光吸収率が 20%以下であることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項81】 請求項73ないし80のいずれかの記 載において、前記蛍光体の平均粒子サイズが当該蛍光体 から発する蛍光の最高強度波長より小さい極微粒子であ

【請求項82】 請求項73ないし80のいずれかの記 載において、前記蛍光体の平均粒子サイズが前記励起光 の最高強度波長より小さい極微粒子であることを特徴と する潜像形成部材。

【請求項83】 請求項63ないし82のいずれかの記 載において、前記印刷層が配達物に設けられていること を特徴とする潜像形成部材。

【請求項84】 請求項63ないし82のいずれかの記 載において、前記印刷層が配達物に貼付されるラベルに 設けられていることを特徴とする潜像形成部材。

【請求項85】 請求項83または84記載において、 前記印刷層が配達関係情報を保有していることを特徴と する潜像形成部材。

【請求項86】 請求項63ないし85のいずれかの記 載において、前記励起光の照射を受けてから発光強度が 最高発光強度の90%に到達するまでの立ち上がり時間 が200µsec以内の蛍光体を用いたことを特徴とす る潜像形成部材。

【請求項87】 請求項63ないし85のいずれかの記 載において、前記励起光の照射を停止して残光の発光強 20 備えた光学読取装置において、 度が最高発光強度の80%減衰するまでの時間が200 μsec以内の蛍光体を用いたことを特徴とする潜像形 成部材。

【請求項88】 蛍光体を担持した潜像形成部材に対し て励起光を照射する発光素子と、前記蛍光体からの光を 反射するミラーと、そのミラーによって反射された光を 受光する受光素子とを備えた光学読取装置において、 前記ミラーの一部に発光素子からの励起光をほとんどす べて透過する透光部を設けるとともに、そのミラーの反 射率が50%を越えていることを特徴とする光学読取装 30 置。

【請求項89】 請求項88の記載において、前記透光 部がミラーのほぼ中央部に設けられ、前記発光素子から の励起光が前記潜像形成部材の表面に対してほぼ垂直に 照射されることを特徴とする光学読取装置。

【請求項90】 請求項88記載において、前記透光部 が励起光の光束よりも大であることを特徴とする光学読 取装置。

【請求項91】 請求項88または89の記載におい て、前記ミラーが全反射ミラーであることを特徴とする 40 光学読取装置。

【請求項92】 蛍光体を含んだバーコードが印刷され た潜像形成部材に対して励起光を照射する発光素子と、 前記蛍光体からの光を受光する受光素子とを備えた光学 読取装置において、

前記発光素子から照射される励起光の放射パターンが前 記バーコードの長手方向に長い楕円形をしていることを 特徴とする光学読取装置。

【請求項93】 請求項92記載において、前記励起光

10

以下であることを特徴とする光学読取装置。

【請求項94】 蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起 光を照射する発光素子と、

前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光累子と、

前記発光素子と受光索子の間の光路上に配置されたスリ ット部材と、

前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段とを 備えた光学読取装置において、

前記搬送手段による潜像形成部材の搬送速度∨が、下記 10 の関係にあることを特徴とする光学読取装置。

d/v≥tu

d:スリット部材の潜像形成部材搬送方向の開口長さ

v:潜像形成部材の搬送速度

tu: 蛍光体が励起光を受けてから発光強度が最高発光 強度の90%に到達するまでの蛍光体の立ち上がり時間 【請求項95】 蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起 光を照射する発光素子と、

前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光素子と、

前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段とを

前記搬送手段による潜像形成部材の搬送速度∨が、下記 の関係にあることを特徴とする光学読取装置。

L/v≥ta

L: 蛍光体を印刷した部分の搬送方向の間隔

v:潜像形成部材の搬送速度

ta:前記励起光の照射を停止して残光の発光強度が最 高発光強度の80%減衰するまでの蛍光体の立ち下がり 時間

【請求項96】 蛍光体を担持した潜像形成部材に励起 光を照射する発光素子と、

前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光素子と、 前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段と、 前記潜像形成部材から受光素子までの光路上で、かつ平 面が前記潜像形成部材と対向するように配置された第1 の凸レンズと、

前記潜像形成部材から受光索子までの光路上で、かつ平 面が前記受光素子と対向するように配置された第2の凸 レンズと、

その第2の凸レンズと受光素子との間に配置されたスリ ツト部材とを備えたことを特徴とする光学読取装置。

【請求項97】 蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起 光を照射する発光素子と、その潜像形成部材からの蛍光 を受光する受光素子とを備えた光学読取装置において、 前記発光素子が半導体レーザダイオードからなり、

その半導体レーザダイオードを駆動する駆動回路がオー トマチックパワーコントロール機能を備え、

前記半導体レーザダイオードから照射される励起光をモ ニタして、その励起光の出力状態を保持するホールド回 路を設け、

の放射パターンの長軸と短軸の比(長軸/短軸)が15 50 そのホールド回路からの信号に基づき前記駆動回路で半

導体レーザダイオードからの励起光の出力状態を制御するように構成されていることを特徴とする光学読取装置。

【請求項98】 蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起 光を照射する発光素子と、

前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光案子と、 前記発光素子と受光素子の間の光路上に配置されたスリット部材と、

前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段と、前記潜像形成部材を区分けする区分け手段とを備え、前記スリット部材の潜像形成部材搬送方向の開口長さ d、搬送手段による潜像形成部材の搬送速度v、蛍光体が励起光を受けてから発光強度が最高発光強度の90%に到達するまでの蛍光体の立ち上がり時間 tu が下記の関係にあって、

d/v≥tu

前記スリット部材に形成されたスリットを透過する励起 光ならびに蛍光より潜像形成部材に設けられた印刷層の 情報を光学的に読み取り、その情報に基づいてて潜像形 成部材を区分けすることを特徴とする品物区分け装置。 【請求項99】 蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起 光を照射する発光案子と、

前記潜像形成部村からの蛍光を受光する受光素子と、前記潜像形成部村を所定の方向に搬送する搬送手段と、前記潜像形成部村を区分けする区分け手段とを備え、蛍光体を印刷した部分の搬送方向の間隔し、搬送手段による潜像形成部村の搬送速度v、励起光の照射を停止して残光の発光強度が最高発光強度の80%減衰するまでの蛍光体の立ち下がり時間taが下記の関係にあり、

L/v≥t₄

搬送されてくる潜像形成部材に設けられた印刷層の情報 を光学的に読み取り、その情報に基づいてて潜像形成部 材を区分けすることを特徴とする品物区分け装置。

【請求項100】 仕分けすべき物品の表面に記載されている仕分け先情報を光学的に読み取る可視像光学読取手段と、

その可視像光学読取手段によって読み取られた仕分け先 情報に基づいて、当該物品上に蛍光体を用いて仕分け先 情報を印刷する蛍光体印刷手段と、

その蛍光体印刷手段によって形成された印刷層の情報を 40 光学的に読み取る潜像光学読取手段と、

その潜像光学説取手段によって読み取られた仕分け先情報に基づいて物品を仕分ける仕分け手段とを備えている ことを特徴とする物品仕分け装置。

【請求項101】 仕分けすべき物品の表面に記載されている仕分け先情報を可視像光学読取手段で光学的に読み取り、

その可視像光学説取手段によって読み取られた仕分け先 情報に基づいて、当該物品上に蛍光体を用いて仕分け先 情報を印刷し、 1 2

その印刷層の情報を潜像光学読取手段で光学的に読み取り、

その潜像光学説取手段によって読み取られた仕分け先情報に基づいて物品を仕分けることを特徴とする物品仕分けシステム。

【請求項102】 照射した励起光に対して異なる波長の光を発する蛍光体を含有した検知用マークにおいて、 記録すべきデータに対応した模様が形成されたデータ部と

10 そのデータ部に対する励起光の照射に先だって走査される部分に形成された導入部とを備え、

その導入部が、前記データ部において形成される模様の 内で最も長い連続部分よりも十分長く連続することを特 徴とする検知用マーク。

【請求項103】 請求項102記載において、前記データ部に形成される模様がバーコード状の模様であって

複数本のバーにより構成される前記データ部と、そのバーが配設される地棋様部とが、蛍光体により反転して媒体上に形成されることにより、

前記導入部がデータ部の周囲を所定幅で包囲して形成されることを特徴とする検知用マーク。

【請求項104】 請求項102または103記載のマークの検出方法において、

ほぼ一定強度の光を照射する光照射工程と、

光の照射位置から放出される光を取り込むとともに、電気信号に変換する光電変換工程と、

マーク中の前記導入部に対応する電気信号から比較値を自動的に設定する比較値設定工程と、

30 マーク中の前記データ部に対応する検出値と前記比較値 とを比べ、検出値が比較値を超えるとマークの形成位置 であると判定するマーク判定工程とを備えたことを特徴 とするマークの検出方法。

【請求項105】 蛍光体を含有したマークに励起光を 照射し、そのマークから発生される蛍光を受光すること により、マークを検出する方法において、

ほぼ一定強度の励起光を断続的に照射する工程と、

その励起光の照射位置から放出される光を入力して電気信号に変換する工程と、

0 光照射期間中における入射光の大きさに対応する電気信 号を比較値として取り出す入射強度検知工程と、

入射光の蛍光成分に対応する大きさの電気信号を検出値 として取り出す蛍光強度検知工程と、

前記検出値と比較値とを比べ、検出値が比較値を上回るとマークの形成位置であると判定する判定工程とを備えたことを特徴とするマークの検出方法。

【請求項106】 請求項105記載において、前記入 射強度検知工程は、励起光の照射開始直前における入射 光の強さと、励起光の照射停止直前における入射光の強 50 さとを個別に検知するとともに、 両者の差を分圧することにより比較値が作成されること を特徴とするマークの検出方法。

【請求項107】 請求項105記載において、前記蛍 光強度検知工程は、励起光の照射停止直後における入射 光の強さを検知することにより検出値が作成されること を特徴とするマークの検出方法。

【請求項108】 請求項105記載において、前記蛍 光強度検知工程は、励起光の照射開始直後における入射 光の強さと、励起光の照射停止直前における入射光の強 さとを個別に検知するとともに、

両者の差をとることにより検出値が作成されることを特 徴とするマークの検出方法。

【請求項109】 照射した励起光に対して異なる波長の光を発する蛍光体を含有した検知用マークに励起光を 照射し、マークから放出される蛍光を検知してマークを 検出する光学説取装置において、

強度がほぼ一定の前記励起光を、所定の周期をもって継 続させながら照射する光照射手段と、

前記励起光の照射位置から放出される光を取り込んで電気信号に変換する光電変換手段と、

前記光照射手段の照射タイミングと同期させ、照射開始 直前に対応する最低値と、照射停止直前に対応する最大 値と、照射停止直後の検出値とを個別に検知可能とする 波形検出手段と、

前記最大値と最低値の差を分圧した比較値と前記検出値 とを比べ、検出値が比較値を超えるとマークの形成位置 と判定するマーク判定手段とを備えたことを特徴とする 光学読取装置。

【請求項110】 請求項109記載において、前記光 電変換手段の入力側に、入射光から蛍光と同一波長の光 30 成分を選択的に取り込む沪波手段を設け、

前記波形検出手段は、所定のタイミングをもって入力波 形の大きさをサンプリングするとともに、その値を次の サンプリング時まで維持し、

その波形検出手段から出力される前記最高値が有意な値 か否かを判定する信号入力判定手段を設け、

その信号入力判定手段が最高値を有為な値と判定した期間においてのみ、前記マーク判定手段の判定動作が可能 になることを特徴とする光学読取装置。

【請求項111】 照射した励起光に対して異なる波長 40 の光を発する蛍光体を含有した検知用マークに励起光を 照射し、マークから放出される蛍光を検知してマークを 検出する光学読取装置において、

強度がほぼ一定の前記励起光を、所定の周期をもって継 続させながら照射する光照射手段と、

前記励起光の照射位置から放出される光を入力して電気 信号に変換する光電変換手段と、

前記光照射手段による照射期間と90度位相がずれたタイミングで同期をとりながら、前記光電変換手段からの出力信号の半分を反転増幅する波形整形手段と、

1.4

その波形整形手段による出力信号から直流成分を選択的 に取り出す低域通過型沪波手段とを備えたことを特徴と する光学読取装置。

【請求項112】 照射した励起光に対して異なる波長の光を発する蛍光体を含有した検知用マークに励起光を 照射し、マークから放出される蛍光を検知してマークを 検出する光学読取装置において、

強度がほぼ一定の前記励起光を、所定の周期をもって 総させながら照射する光照射手段と、

10 前記励起光の照射位置から放出される光から、蛍光の波 長成分の光を選択的に取り込む沪波手段と、

その
ア波手段を介して取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換手段と、

前記光照射手段の照射期間と90度位相がずれたタイミングで同期をとりながら、前記光電変換手段からの出力信号の半分を反転増幅する波形整形手段と、

その波形整形手段による出力信号から直流成分を選択的に取り出す低域通過型沪波手段と、

その低域通過型沪波手段から出力される検出電圧を設定 電圧と比較し、検出電圧が設定電圧を超えると所定の検 知信号を出力する比較手段とを備えたことを特徴とする 光学読取装置。

【請求項113】 請求項112記載において、前記波 形整形手段は、差動増幅回路の2つの入力端にアナログ スイッチを各々介して並列に接続するとともに、

一方のアナログスイッチを、光照射期間と90度位相が 遅れた期間に対応させてオンさせ、

他方のアナログスイッチを、光照射期間と90度位相が 進んだ期間に対応させてオンさせるように構成したこと を特徴とする光学読取装置。

【請求項114】 蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍光体の励起光を照射する投光部と、

前記蛍光体から発する蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号に変換する受光部と、

その受光部から出力される電気信号を増幅する増幅部

その増幅部の出力信号から前記潜像によって記録された 情報を検出する信号検出部とを備えた光学読取装置にお いて

の前記増幅部の増幅率を前記受光部に入射する前記反射光の強度に応じて切り換え可能に構成し、

ピーク値が予め定められた所定値以下の当該増幅部の出力信号を前記信号検出部に取り込んでA/D変換し、前記潜像の形成パターンに対応する2値化信号を得るように構成されていることを特徴とする光学読取装置。

【請求項115】 蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍光体の励起光を照射する投光部と、

前記蛍光体から発する蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号に変換する受光部と、

50 その受光部から出力される電気信号を増幅する増幅部

と、

その増幅部の出力信号から前記潜像によって記録された 情報を検出する信号検出部とを備えた光学読取装置にお

前記増幅部の増幅率を前記受光部に入射する前記反射光 の強度及び前記蛍光の強度に応じて切り換え可能に構成

ピーク値が予め定められた所定値以下の当該増幅部の出 力信号を前記信号検出部に取り込んでA/D変換し、前 記潜像の形成パターンに対応する2値化信号を得るよう に構成されていることを特徴とする光学読取装置。

【請求項116】 請求項114または115記載にお いて、前記ワークの通過経路を介して、その通過経路の 一方側に前記投光部と受光部とを配置し、通過経路の他 方側に前記励起光を吸収する吸収体を投光部ならびに受 光部と対向するように配置し、

前記投光部の作動中であって、投光部及び受光部と吸収 体との間に前記ワークが存在しないとき、前記受光部か らの出力信号がほぼグランドレベルとなるように調整さ れていることを特徴とする光学読取装置。

【請求項117】 請求項114または115記載にお いて、前記ワークの通過経路を介して、その通過経路の 一方側に前記投光部と受光部とを配置し、通過経路の他 方側に前記励起光を反射する反射体を投光部ならびに受 光部と対向するように配置し、

前記投光部の作動中であって、投光部及び受光部と吸収 体との間に前記ワークが存在しないとき、前記受光部か らの出力信号が飽和レベルとなるように調整されている ことを特徴とする光学読取装置。

クに、前記蛍光体の励起光を照射する投光部と、

前記蛍光体から発する蛍光及び前記ワークからの反射光 を受光して電気信号に変換する受光部と、

その受光部から出力される電気信号を増幅する増幅部

その増幅部の出力信号から前記潜像によって記録された 情報を検出する信号検出部とを備えた光学読取装置にお いて、

前記増幅部の出力信号を前記信号検出部に取り込み、そ スレベルを有する2以上のスライス信号でスライスし、 得られた2以上の2値化信号の論理和をとることによ り、前記潜像に対応する2値化信号を得るように構成さ れていることを特徴とする光学読取装置。

【請求項119】 蛍光体を含む潜像が形成されたワー クに、前記蛍光体の励起光を照射する投光部と、

前記蛍光体から発する蛍光及び前記ワークからの反射光 を受光して電気信号に変換する受光部と、

その受光部から出力される電気信号を増幅する増幅部

16

その増幅部の出力信号から前記潜像によって記録された 情報を検出する信号検出部とを備えた光学読取装置にお いて、

前記信号検出部に、増幅率が低い値に設定されていると きの前記増幅部の出力信号と、増幅率が高い値に設定さ れているときの前記増幅部の出力信号とを取り込み、そ の信号検出部で前記増幅部の出力信号を特定のスライス レベルを有する1つのスライス信号でスライスし、これ により得られた2以上の2値化信号の論理和をとること 10 によって、前記潜像に対応する2値化信号を得るように 構成されていることを特徴とする光学読取装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、発光性能の良好な蛍光 体、その蛍光体の製造方法、その蛍光体を含有するイン クジェットプリンタ用インクなどの蛍光体組成物、その 蛍光体組成物で印刷された潜像を有する例えば郵便物な どの潜像形成部材、その潜像を光学的に高速で読み取る ことのできる光学読取装置ならびに光学読取システムな 20 どに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

(従来技術1)近年、流通産業界を中心に各産業界でバ ーコードによる物の管理などが盛んに行われたり、ま た、各種プリペイドカードあるいは通行カードなどにも バーコードが印刷され、スキャナなどの光学読取装置を 用いてこのバーコードを読み取り、所定の処理動作が行 われるようになっている。

【0003】種々の物品の表面に赤外領域の蛍光を発す 【請求項118】 蛍光体を含む潜像が形成されたワー 30 る蛍光体で識別のための潜像(例えばバーコードなど) を形成し、これを光学読取装置で読み取って、物品を処 理するシステムが開発されている。この潜像を使用した システムは、従来の黒色などの可視領域のインクによる マークを物品表面に形成し、可視光の反射率の変化を利 用してマークを読み取るシステムに比較して、例えば次 のような特長を有している。

> 【0004】①、物品の色彩によって、潜像の読み取り に誤りを生じることが少なく、信頼性が高い。

【0005】②. 潜像形成面が汚れても、発光する赤外 の信号検出部で前記増幅部の出力信号を2以上のスライ 40 光が長波長のため、読み取りに誤りを生じることが少な く、信頼性が高い。

> 【0006】3. 蛍光体は視覚的に無色に近いため、商 品の表面に印刷しても外観を損ねたりすることがない。 【0007】 ②. 潜像であるため他人に認識され難く、 情報の秘密保持に役立つ。

> 【0008】従来、この種の関連技術として例えば特公 昭55-33837号公報、特公昭60-29996号 公報ならびに特公昭62-24024号公報などに記載 された発明がある。

【0009】(従来技術2)従来、データーカードなど

に用いられる赤外蛍光体インクとしては、ネオジム(Nb)、イッテルビウム(Yb)およびエルビウム(Er)を含有した無機の蛍光体が知られている(例えば米国特許明細書第4,202,491号参照)。

【0010】これらのうち、光学活性元素としてNbを単独で用いた無機蛍光体は、励起波長が800nmのGaA1As発光ダイオードを使用すると蛍光の最高強度波長は1050nm付近であり、光学活性元素としてNbとYbの2種を含有する無機蛍光体は、励起波長が800nmのGaA1As発光ダイオードを使用すると蛍 10光の最高強度波長は980nm付近であり、光学活性元素としてYbとErの2種を含有する無機蛍光体は、励起波長が940nmのGaAs発光ダイオードを使用すると蛍光の最高強度波長は1540nm付近であり、光学活性元素としてNd、Yb、Erの3種を含有する無機蛍光体は、励起波長が800nmのGaA1As発光ダイオードを用いると蛍光の最高強度波長は1540nm付近であることが知られている。

【0011】(従来技術3)例えば特公昭56-4598号公報に示されているように、赤外領域の光に対して20大きな吸収特性を有するNdを光学活性元素として用い、その光学活性元素から発光中心への励起エネルギーの伝達効率の高い母体材料であるアルカリ金属塩(例えばNa2MoO4等)、Si光検出器との波長のマッチングが良い発光中心であるYb等、専ら発光強度に重点をおいた材料が選ばれていた。

【0012】(従来技術4)従来、赤外波長領域で発光する蛍光体を用いてマーク(潜像)を形成し、このマークに照射される励起光と蛍光体から発する蛍光の発光中心波長が異なることを利用し、光学フィルタを用いて蛍 30光のみを反射光(励起光)中から分離することによって、マークの有無を判定する方法が知られる(例えば特公昭54-22326号、特公昭61-18231号公報参照)。

【0013】また本出願人は以前、蛍光体で形成したマーク上に励起光を間欠的に照射し、その照射の停止期間中にマークから発生する残光の有無を検出することによって、マークの形成位置を検知する方法および装置を提案した(例えば特開平3-16369号公報、特開平5-20512号公報参照)。

【0014】(従来技術5)図70は、従来の光学読取装置の概略構成を示す図である。同図に示すように、潜像パーコード401は、特定波長の光、例えば赤外線402を照射することによって励起され、その赤外線402とは異なる波長の蛍光403を発光する蛍光体微粒子をバインダ中に分散、保持してなるインクをもって、ワーク404上に印刷によって形成される。

【0015】この潜像バーコード401から情報を読み るという特性を有している。そこで従来の蛍光体は励起 取る装置は、前記赤外線402を照射する発光部405 光の照射を開始して発光強度が所望の値になるまでの時 と、前記潜像バーコード401からの蛍光403及び前 50 間、すなわち立ち上がり時間が長い。そのために潜像形

記ワーク404からの反射光406を入射し、電気信号に変換する受光部407と、電気信号を増幅するアンプ408と、該そのアンプ408の出力信号(以下、この信号を「アナログ再生信号」という。)から前記潜像バーコード401によって記録された情報を検出する信号検出部409とを有している。

18

【0016】この信号検出部409はA/D変換器を備えており、A/D変換器で前記アナログ再生信号を2値化して、前記潜像バーコード401に記録された情報を再生する。

【0017】一般に、アナログ再生信号の2値化にはコンパレータが用いられており、このコンパレータの入力部に図71に示すようなアナログ再生信号aと一定レベルのスライス信号bを入力し、アナログ再生信号aをそのスライス信号bにてスライスして、2値化信号を得ている。

[0018]

【発明が解決しようとする課題】

(技術課題1)従来種々提案された蛍光体、その蛍光体 を含有した印刷層を有する潜像形成部材などでは、蛍光 体の粒子径と、使用する励起光の波長との関係ならびに 蛍光体から発する蛍光の波長との関係については考慮さ れていなかった。

【0019】すなわち従来の蛍光体は、その粒子径が例えば5~6μm程度と比較的大きい。一方、蛍光体を励起する光源として例えば半導体レーザが使用され、その波長は0.8μm程度であり、また従来の蛍光体から発する光の波長は1μm程度であった。

【0020】このように従来の蛍光体粒子は、励起光ならびに蛍光の波長の約5~7.5倍もあり、非常に大きな粒子である。そのためこの蛍光体粒子を含有した潜像印刷層を形成したとき、粒子の重なり合いが多くあり、印刷層に励起光を照射した際に印刷層の深部にある蛍光体粒子まで励起光が到達せず、そのために蛍光体の活性効率(励起効率)が悪い。

【0021】また、印刷層深部の蛍光体粒子が励起されて蛍光を発したとしても、その上側にある他の蛍光体粒子によって遮断され、そのため印刷層表面から発する蛍光量が少ない。

40 【0022】このように従来の蛍光体は、蛍光体の活性 効率(励起効率)が悪いことと、折角蛍光を発してもそ れが印刷層表面から放射されない光があることから、結 果的には発光強度が弱く、潜像検出の信頼性に問題があ る。

【0023】(技術課題2) 蛍光体は励起光の照射を受けて活性化し、そのために蛍光の発光量が次第に増え、励起光の照射を停止すると蛍光の発光量が次第に減少するという特性を有している。そこで従来の蛍光体は励起光の照射を開始して発光強度が所望の値になるまでの時間、すなわち立ち上がり時間が長い、そのために薄像形

成部材と光学読取装置との相対的速度を余り速くすることができず、高速読取りに障害となっており、前記相対 的速度を速くすると潜像印刷層が保有している情報を正確に読み取ることができなくなる。

【0024】この蛍光体の立ち上がり時間が長いこととも関係することであるが、励起光の照射を停止してからの残光強度が実質的に零になるまでの時間、すなわち立ち下がり時間が長い。そのためバーコード状の印刷層を形成した場合、バーの間隔を狭くすると隣のバーの残光までも受光索子が受光してしまい、情報の適正な読み取 10りができない。

【0025】(技術課題3)前述のようなNb, Yb, Erなどの無機粉末の蛍光体顔料は、粒子サイズが比較的大きい。このことは樹脂などで固めて使用に供する場合にはさほど問題は無いが、例えばインクジェットプリンタ用インクなどとして使用する場合には、蛍光体の粒子サイズをできるだけ小さくしておかなければ均質で綺麗な印字ができず、読み取り時に高い分解能が得られない。またその反面、蛍光体粒子をミルなどで細かく粉砕すると極端に蛍光出力が低下するという不都合があった。

【0026】さらに、本発明者らの検討によれば、これらの無機蛍光体顔料は、前述の問題点の他にも応答速度が著しく遅く、そのために高速で読み取ることができないという問題があった。

【0027】(技術課題4)前述の特公昭56-4598号公報において、赤外発光蛍光体の母体材料は、アニオンをMoO2²-、WO4²-としたとき、カチオンをアルカリ金属であるLi*Na*及びK*で構成することが記載されている。一般に1価の金属であるアルカリ金30属の塩は、価数が低いためにアニオンとのイオン結合力が弱く、容易に結合が切れて水和物となるため水溶性である。従って、これを母体材料に用いた蛍光体の耐水性は非常に悪く、実用環境での耐久性においてこの低い耐水性は問題となる。

【0028】さらに、赤外発光蛍光体の作製は、蛍光体 材料の出発原料(例えばNa2 CO3、MoO3、Nd 2 O3、Yb2 O3)のみを目的の組成になるように秤 量し、混合、加圧成型してから焼成し、その後に機械的 に粉砕することで粉末状の蛍光体を得ている。

【0029】この場合、得られた蛍光体の粒子サイズは 細かくてもせいぜい約5μmであり、スクリーン印刷な どの印刷法におけるインクには適用可能であはあるもの の、ユーザーが個々に印刷するのに適したインクジェッ トプリンター、インクリボン等には応用が困難である。 なぜならこれらの印刷法に用いるインクには、粒子サイズが1μm以下の蛍光体粉が必要であるにも拘らず、前 述の如く粒子サイズが大きいため、インクジェットプリ ンターやインクリボン等には不向きである。

【0030】また、例えば特開平5-261634号に 50 ラーを通して受光素子で受光する構成になっていた。

20

示されているように、PO4 系の塩を母体材料としてN dやYbを付活した蛍光体で、粒子サイズを0.1~3 μmとすることにより、オフセット印刷やインクリボンに使用可能になるとされていた。

【0031】ところが、この系の赤外発光蛍光体は、励起光を照射してから発光が最大値を示すまでの立ち上がり時間及び、励起光の照射を止めてから発光が消失するまでの残光時間が非常に長いため、短パルス光励起、高速スキャン等の高速読み取りには不向きであった。

【0032】本発明者らは、このような観点から応答速度の速い赤外発光蛍光体を開発するために、当初、母材としてNa2 MoO4 を検討したが、これは水溶性であるから、この母材に光学活性元素を添加した蛍光体の耐水性は悪かった。また、蛍光体の粒子サイズは数μm以上あり、インクジェットプリンター、インクリボン、オフセット等の印刷法に対しては、粒子サイズが大きすぎて実用的ではない。

【0033】(技術課題5)従来、蛍光体粒子を含むインクジェットプリンター用インクなどの蛍光体組成物に20 ついては、使用する蛍光体の粒子径と、蛍光体密度/バインダ密度、粘度、表面張力、比抵抗、pH値などとの関係については考慮されていなかった。

【0034】そのため組成物中で蛍光体粒子が沈降して分散安定性が悪くなったり、印刷時に滲み出しがあったり、発光出力が小さいなどの問題を有していた。

【0035】(技術課題6)従来の蛍光体粒子を含む印刷層では蛍光体の含有率が30~85重量%あり、特に無機化合物で前述のように粒子径の大きい蛍光体が使用されていた。このように蛍光体の含有率が多いと印刷層が盛り上がり、印刷層の存在が分かってしまうことがある。このことは特に外観を損ねたくない個所に印刷層を形成する場合、あるいはセキュリティを持たせるために印刷層を形成する際に問題となる。

【0036】(技術課題7)従来の蛍光体粒子を含む印刷層では、それの表面粗さについて考慮されていなかった。特に前述のように粒子径の大きい蛍光体が使用されていたため、印刷層の表面粗さは比較粗く微細な凹凸が多数あり、そのため励起光を印刷層表面に照射しても表面で乱反射が生じ、印刷層内部に侵入する励起光量が少40なくなる。

【0037】また印刷層の表面粗さが粗いと、印刷層内 部で発生した蛍光が表面で散乱する傾向にあり、そのた め受光素子に受光される光量が少ない。

【0038】このようなことから受光素子の出力が低く、そのため潜像検出の信頼性に問題がある。

【0039】(技術課題8)従来の光学読取装置では、 潜像の検出光路上にハーフミラーが配置され、発光素子 から出射された励起光をハーフミラーを通して潜像形成 部材に照射し、潜像形成部材から発した蛍光をハーフミ ラーを通して受光素子で受光する構成になっていた

【0040】そのため励起光がハーフミラーを透過する 際に励起光の約半分が潜像形成部材以外の方向に反射さ れ、また、蛍光がハーフミラーを透過する際に蛍光の約 半分が受光素子以外の方向に反射される。そのため実際 に蛍光体を活性化する励起光量が少なく、よって発生す る蛍光量も少ないが、さらにその蛍光の半分程度しか受 光素子に受光されないから、受光素子の出力が低く、潜 像検出の信頼性に問題がある。

【0041】(技術課題9)従来の光学読取装置では、 発光素子から照射される励起光の放射パターンが円形を 10 す。 しており、この円形スポットで潜像のバーコードを照射 していた。そのため照射面積が十分にとれず、結果的に は発光強度が低い。照射面積を増やすために円形スポッ トの径を大きくしょうとすると、隣のバーコードまで照 射することことになり、S/Nが低くなる。このような ことから、潜像検出の信頼性に問題がある。

【0042】(技術課題10)従来の光学読取装置で は、使用している蛍光体の励起光を受けたときの立ち上 がり時間、ならびに潜像形成部材搬送方向のスリット幅 と、潜像形成部材の搬送速度との関係については配慮さ 20 れていなかった。

【0043】また、励起光の照射を停止した際の蛍光体 の立ち下がり時間、ならびに潜像形成部材におけるバー の間隔と、潜像形成部材の搬送速度との関係については 配慮されていなかった。

【0044】そのために潜像形成部材に形成されている 印刷層の情報が適正に読み取れないことがあった。

【0045】(技術課題11)従来の光学読取装置で は、潜像形成部材と対物レンズとの間にスリット部材を 介在して、搬送される潜像形成部材からの蛍光のうちで 30 検出すべき蛍光だけをスリットを介して受光する構成に なっている。

【0046】前記潜像形成部材の厚さがほぼ一定の場合 には問題にならないが、潜像形成部材の厚さが不定で、 厚い潜像形成部材が搬送されて来た場合、潜像形成部材 の先端部がスリットに当接して潜像形成部材の搬送が停 止したり、スリットに損傷をきたすなどの欠点を有して いる。

【0047】(技術課題12)前述の特公昭54-22 326号公報、特公昭61-18231号公報、特開平 3-16369号公報ならびに特開平5-20512号 公報などに記載されているマークの検出方法は何れも、 励起光の照射によってマークから発生する蛍光を検出器 で検出することによりマーク形成位置を判定するもので ある。しかしながら、この検出器に入射する光量はその 検出環境や条件の変化に対応して激しく変動するため、 マーク位置の高い検出精度を常に維持するためには、複 雑な回路処理が必要であったり、使用条件が限定される などの不都合があった。

行なった結果、前記した蛍光を検知する方法にあっては 何れも、データ部分以外から得られる情報が少ないため に検出条件の変化を的確に捉えることが困難である。

【0049】(技術課題13)従来の光学フィルタを用 いて励起光の反射光と蛍光とを分離する方法にあって は、両方の光の発光中心波長が接近するとともに、反射 光の強度に比べて蛍光の強度は極めて弱いため、両方の 光を的確に分離することが技術的に難しく、ともすると 反射光の成分が大量に残って検出精度の低下をもたら

【0050】一方、前記した残光を利用する方法では、 反射光の有無は問題とならずに蛍光のみを有効に分離し て検出できるが、検出器の受光面にゴミが付着すると検 出感度が低下し、マークから発生する残光の絶対値も下 がり、残光の検出精度が低下する。

【0051】(技術課題14)特開平3-16369号 公報ならびに特開平5-20512号公報などに記載さ れている潜像の検出方法では、蛍光の波長と同一か近傍 の波長の外部光があると、その光がそのまま受光素子に 入力されて電気信号に変換されるため、蛍光が発生して いないにもかかわらずそれを蛍光と誤認する底れがあ

【0052】そこでかかる誤認を未然に防止するため、 光の照射および検出位置を外部光から遮蔽して使用する ことが要求されるなど、使用環境が限定される不都合が あった。

【0053】(技術課題15)前記図71に示す光学読 取装置の前記アナログ再生信号のレベルや振幅は、前記 潜像バーコードが形成される下地の物性によって大きく 影響される。即ち、下地が透明インクを吸収しやすく、 かつ前記投光部から照射される励起光を吸収しやすい素 材からなる場合には、潜像バーコードからの発光量及び 下地からの反射光量が少なくなるため、図71(b)に 示すようにアナログ再生信号のレベルが低く、かつその 信号振幅が小さくなる。

【0054】また、下地が透明インクを吸収しやすく、 かつ投光部から照射される光を反射しやすい素材からな る場合には、図71(c)に示すようにアナログ再生信 号が高レベル側にオフセットする。さらに、下地が透明 40 インクを吸収しにくく、かつ前記投光部から照射される 光を吸収しやすい素材からなる場合には、図71(a) に示すようにアナログ再生信号は、信号振幅が大きくな る.

【0055】従って、潜像バーコードが形成される下地 の相違に起因するアナログ再生信号の波形の変動につい て何ら考慮されていない従来の読取装置では、例えば下 地の素材が異なる各種のワークに潜像バーコードを形成 しておき、これを1つの読取装置で読み取る場合、ある いは1つのワークが各種の素材からなり、その各部にま 【0048】本発明者らはかかる不都合に鑑みて考察を 50 たがって形成された潜像バーコードを読取装置で読み取

る場合に、潜像バーコードを正確に読み取れないという 不都合を生じやすい。なお、前記受光部の前面に潜像バ ーコードからの蛍光のみを透過し、下地からの反射光を 全部カットする光学フィルタ(単波長フィルタ)を設け れば、かかる不都合を回避できる。しかし、単波長フィ ルタは高価であって、コストの点から実機には到底搭載 することができず、通常は、前記反射光の一部をカット する帯域フィルタが設置されるので、前記の不都合が問 題になる。

【0056】本発明の目的は、前述した従来技術の欠点 10 DE1-x Lnx Pv Oz を解消し、発光出力が大きく、信頼性の高い蛍光体、蛍 光体組成物、潜像形成部材、光学読取装置、物品仕分け 装置ならびに物品仕分けシステムを提供することにあ

【0057】本発明の他の目的は、前述した従来技術の 欠点を解消し、耐久性に優れ、インクジェットプリンタ ーやインクリボン等の印刷法にも適した微細粒子の応答 速度の速い蛍光体ならびに蛍光体組成物を提供すること にある。

【0058】本発明の他の目的は、前述した従来技術の 20 欠点を解消し、データの検知環境の変化が容易且つ的確 に判断できる光学式の検知用マークを提供することにあ る。本発明の他の目的は、前述した従来技術の欠点を解 消し、マークから発生される蛍光の検出条件の劣化にも かかわらず、的確にマーク形成位置の検出が行なえる検 出方法および光学読取装置を提供することにある。

【0059】本発明の他の目的は、前述した従来技術の 欠点を解消し、使用環境に影響されることなく、潜像マ 一クの検知が確実に行なえる光学読取装置を提供するこ

【0060】本発明の他の目的は、前述した従来技術の 欠点を解消し、高価な単波長フィルタを用いることな く、アナログ再生信号の波形の如何に拘らず、常に潜像 を正確に読み取ることができる読み取り装置を提供する ことにある。

[0061]

【課題を解決するための手段】第1の本発明は、前述の 目的を達成するため、照射した励起光に対し、異なる波 長の光を発する蛍光体において、その蛍光体の平均粒子 サイズが該蛍光体から発する蛍光の最高強度波長より小 40 さい極微粒子状であることを特徴とするものである。

【0062】第2の本発明は、前述の目的を達成するた め、照射した励起光に対し、異なる波長の光を発する蛍 光体において、その蛍光体の平均粒子サイズが前記励起 光の最高強度波長より小さい極微粒子状であることを特 徴とするものである。

【0063】第3の本発明は、前述の目的を達成するた め、蛍光体が、光学活性元素としてNd、Yb、Erの いずれか1種以上の元素を含む、例えば下記の一般式

を特徴とするものである。 【0064】一般式(1)

Lnx A1-x PO4

式中LnはNd,Yb,Erのグループから選択された 少なくとも1種の元素、AはY, La, Gd, Bi, C e、Lu、In、Tbのグループから選択された少なく とも1種の元素、Xは0.01~0.99の範囲の数 値。

24

【0065】一般式(2)

式中DはLi, Na, K, Rb, Csのグループから選 択された少なくとも1種の元素、EはY, La, Gd, Bi, Ce, Lu, In, Tbのグループから選択され た少なくとも1種の元素、LnはNd, Yb, Erのグ ループから選択された少なくとも1種の元素、XはO. 01~0.99の範囲の数値、Yは1~5の範囲の数 値、Zは4~14の範囲の数値。

【0066】第4の本発明は、前述の目的を達成するた め、蛍光体が、光学活性元素としてFeとErを有し、 その光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y,

Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択され た少なくとも1種の元素を含有している、例えば下記の 一般式(3)、(4)、(5)を有することを特徴とす るものである。

【0067】一般式(3)

G₃ J₅ O₁₂

一般式(4)

GJO3

一般式(5)

30 G2 J4 O12

式中GはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Erからな り、JはSc. Ga, Al, Inのグループから選択さ れた少なくとも1種の元素と、Feからなる。

【0068】第5の本発明は、前述の目的を達成するた め、蛍光体が、光学活性元素としてYbを有し、その光 学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択された少な くとも1種の元素を含有した、例えば下記の一般式

(6)、(7)、(8)を有することを特徴とするもの である。

【0069】一般式(6)

L3 M5 O12

一般式(7)

LMO3

- 一般式(8)

L2 M4 O12

式中LはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループ から選択された少なくとも1種の元素と、Ybからな (1)、(2)を有する含酸素酸塩化合物からなること 50 り、MはSc, Ga, Al, Inのブループから選択さ

れた少なくとも1種の元素からなる。

•(

【0070】第6の本発明は、前述の目的を達成するた め、赤外線に対して吸収特性を有する例えばポリメチン 系、アントラキノン系、ジチオール金属系、フタロシア ニン系、インドフェノール系、アゾ系色素などの有機物 を担持させたNb、Yb、Erのグループから選択され た1種以上の希土類含有有機物からなることを特徴とす るものである。

【0071】第7の本発明は、前述の目的を達成するた め、光学活性元素として少なくともNbまたYbを有 し、その光学活性元素の他にMoまたはWの少なくとも 1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを含有した、例え ば下記の一般式(9)、(10)を有することを特徴と するものである。

【0072】一般式(9)

 $(Nd_{1}-x Ybx)_{Y}Q_{Z}(RO_{4})$

式中QはCa, Mg, Sr, Baのグループから選択さ れた少なくとも1種の元素、MはMo, Wのグループか ら選択された少なくとも1種の元素、Xは0~1の範囲 下の数値。

【0073】一般式(10)

(Nd1-x Ybx) 24 Q8-34 (RO4) 8

式中QはCa、Mg、Sr、Baのグループから選択さ れた少なくとも1種の元素、MはMo, Wのグループか ら選択された少なくとも1種の元素、Xは0~1の範囲 の数値、Yは0を超え8/3の範囲の数値。

【0074】第8の本発明は、前述の目的を達成するた め、T2 RO4 · nH2 O (ただし式中TはLi, N a, Kのグループから選択された少なくとも1種の元 素、RはMo、Wのグループから選択された少なくとも 1種の元素、nはO以上の数値)で示される塩を含むフ ラックス材料に、NdまたはYbの少なくとも1種の光 学活性元素と、MoまたはWの少なくとも1種の酸化物 と、アルカリ土類金属とを入れて焼成した後、前記フラ ックス材料を溶剤で溶解して除去することを特徴とする ものである。第9の本発明は、前述の目的を達成するた め、蛍光体組成物が、照射した励起光に対して異なる波 長の蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記蛍光の 最高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体と、前記励 起光ならびに蛍光に対して透過性を有するバインダと、 溶剤とを含有したことを特徴とするものである。

【0075】第10の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体組成物が、照射した励起光に対して異なる 波長の蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前記励起 光の最高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体と、前 記励起光ならびに蛍光に対して透過性を有するバインダ と、溶剤とを含有したことを特徴とするものである。

【0076】第11の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体組成物が、赤外線に対して吸収特性を有す 50 とするものである。 26

る有機物を担持させたNb、Yb、Erのグループから 選択された1種以上の希土類含有有機物からなる蛍光体 と、有機バインダーとを含有することを特徴とするもの

【0077】第12の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体組成物が、光学活性元素として少なくとも NbまたはYbを有し、その光学活性元素の他にMoま たはWの少なくとも1種の酸化物とアルカリ土類金属と を含有した蛍光体と、有機バインダーとを含有すること 10 を特徴とするものである。

【0078】第13の本発明は、前述の目的を達成する ため、インクリボンにおいて、光学活性元素として少な くともNbまたはYbを有し、その光学活性元素の他に MoまたはWの少なくとも1種の酸化物とアルカリ土類 金属とを含有した蛍光体を有機バインダーに分散、保持 させた蛍光体組成物を、テープ状基材に塗布したことを 特徴とするものである。

【0079】第14の本発明は、前述の目的を達成する ため、潜像形成部材において、照射した励起光に対して の数値、YはOを超え1未満の数値、ZはOを超え1以 20 異なる波長の蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前 記蛍光の最高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体を 含む潜像印刷層を有していることを特徴とするものであ

> 【0080】第15の本発明は、前述の目的を達成する ため、潜像形成部材において、照射した励起光に対して 異なる波長の蛍光を発し、かつその平均粒子サイズが前 記励起光の最高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体 を含む潜像印刷層を有していることを特徴とするもので ある。

【0081】第16の本発明は、前述の目的を達成する ため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体粒子を含有した潜像印刷層を有する潜像形成部材 において、前記印刷層中の蛍光体粒子の含有率が1重量 %を超えて30重量%未満であることを特徴とするもの である。

【0082】第17の本発明は、前述の目的を達成する ため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体粒子を含有した潜像印刷層を有する潜像形成部材 において、前記印刷層の厚さが前記蛍光体粒子の粒子サ イズの35倍以内であることを特徴とするものである。

【0083】第18の本発明は、前述の目的を達成する ため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体粒子とバインダとを含有した潜像印刷層を有する 潜像形成部材において、前記バインダの励起光ならびに 蛍光に対する光透過率が80%以上であることを特徴と するものである.

【0084】第19の本発明は、前述の目的を達成する ため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体粒子が繊維の集合体上に付着していることを特徴

【0085】第20の本発明は、前述の目的を達成する ため、潜像形成部材において、照射した励起光に対して 異なる波長の蛍光を発する蛍光体を含む潜像印刷層の可 視光吸収率が20%以下であることを特徴とするもので ある。

【0086】第21の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光休を担持した潜像形成部材に対して励起光を 照射する発光素子と、前記蛍光体からの光を反射するミ ラーと、そのミラーによって反射された光を受光する受 一部に発光素子からの励起光をほとんどすべて透過す る、例えば透孔などからなる透光部を設けるとともに、 そのミラーの反射率が50%を越した、例えば前面鏡な どの全反射ミラーであることを特徴とするものである。 【0087】第22の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を含んだバーコードが印刷された潜像形成 部材に対して励起光を照射する発光素子と、前記蛍光体 からの光を受光する受光素子とを備えた光学読取装置に おいて、前記発光素子から照射される励起光の放射パタ ーンが前記バーコードの長手方向に長い楕円形をしてい 20 れていることを特徴とするものである。 ることを特徴とするものである。

【0088】第23の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起光を照射す る発光索子と、前記潜像形成部材からの蛍光を受光する 受光素子と、前記発光素子と受光素子の間の光路上に配 置されたスリット部材と、前記潜像形成部材を所定の方 向に搬送する搬送手段とを備えた光学読取装置におい て、前記搬送手段による潜像形成部材の搬送速度vが、 下記の関係にあることを特徴とするものである。

[0089]d/v≥tu

d:スリット部材の潜像形成部材搬送方向の開口長さ v:潜像形成部材の搬送速度

tu: 蛍光体が励起光を受けてから発光強度が最高発光 強度の90%に到達するまでの蛍光体の立ち上がり時間 第24の本発明は、前述の目的を達成するため、蛍光体 を印刷した潜像形成部材に励起光を照射する発光素子 と、前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光素子 と、前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段 とを備えた光学読取装置において、前記搬送手段による 潜像形成部材の搬送速度 v が、下記の関係にあることを 40 特徴とするものである。

【0090】L/v≥ta

L: 蛍光体を印刷した部分の搬送方向の間隔

v:潜像形成部材の搬送速度

ta:前記励起光の照射を停止して残光の発光強度が最 高発光強度の80%減衰するまでの蛍光体の立ち下がり、

第25の本発明は、前述の目的を達成するため、蛍光体 を担持した潜像形成部材に励起光を照射する発光業子 と、前記潜像形成部材からの蛍光を受光する受光素子

と、前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する搬送手段 と、前記潜像形成部材から受光素子までの光路上で、か つ平面が前記潜像形成部材と対向するように配置された 第1の凸レンズと、前記潜像形成部材から受光素子まで の光路上で、かつ平面が前記受光素子と対向するように 配置された第2の凸レンズと、その第2の凸レンズと受 光素子との間に配置されたスリット部材とを備えたこと を特徴とするものである。

28

【0091】第26の本発明は、前述の目的を達成する 光素子とを備えた光学読取装置において、前記ミラーの 10 ため、蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起光を照射す る発光素子と、その潜像形成部材からの蛍光を受光する 受光素子とを備えた光学読取装置において、前記発光素 子が半導体レーザダイオードからなり、その半導体レー ザダイオードを駆動する駆動回路がオートマチックパワ ーコントロール機能を備え、前記半導体レーザダイオー ドから照射される励起光をモニタして、その励起光の出 力状態を保持するホールド回路を設け、そのホールド回 路からの信号に基づき前記駆動回路で半導体レーザダイ オードからの励起光の出力状態を制御するように構成さ

> 【0092】第27の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起光を照射す る発光素子と、前記潜像形成部材からの蛍光を受光する 受光素子と、前記発光素子と受光素子の間の光路上に配 置されたスリット部材と、前記潜像形成部材を所定の方 向に搬送する搬送手段と、前記潜像形成部材を仕分ける 仕分け手段とを備え、前記スリット部材の潜像形成部材 搬送方向の開口長さd、搬送手段による潜像形成部材の 搬送速度v、蛍光体が励起光を受けてから発光強度が最 30 高発光強度の90%に到達するまでの蛍光体の立ち上が り時間も』が下記の関係にあり、

d/v≥t_u

前記スリット部材に形成されたスリットを透過する励起 光ならびに蛍光より潜像形成部材に設けられた印刷層の 情報を光学的に読み取り、その情報に基づいて前記潜像 形成部材を仕分けることを特徴とするものである。

【0093】第28の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を印刷した潜像形成部材に励起光を照射す る発光索子と、前記潜像形成部材からの蛍光を受光する 受光素子と、前記潜像形成部材を所定の方向に搬送する 搬送手段と、前記潜像形成部材を仕分ける仕分け手段と を備え、蛍光体を印刷した部分の搬送方向の間隔し、搬 送手段による潜像形成部材の搬送速度v、励起光の照射 を停止して残光の発光強度が最高発光強度の80%減衰 するまでの蛍光体の立ち下がり時間も。が下記の関係に あり、

L/v≥ta

搬送されてくる潜像形成部材に設けられた印刷層の情報 を光学的に読み取り、その情報に基づいていて前記潜像 50 形成部材を仕分けることを特徴とするものである。

【0094】第29の本発明は、前述の目的を達成するため、物品仕分け装置において、仕分けすべき物品の表面に記載されている仕分け先情報を光学的に読み取る可視像光学読取手段と、その可視像光学読取手段によって読み取られた仕分け先情報を超いて、当該物品上に蛍光体を用いて仕分け先情報を印刷する蛍光体印刷手段と、その蛍光休印刷手段によって形成された印刷層の情報を光学的に読み取る潜像光学読取手段と、その潜像光学読取手段によって読み取られた仕分け先情報に基づいて物品を仕分ける仕分け手段とを備えていることを特徴 10とするものである。

【0095】第30の本発明は、前述の目的を達成するため、仕分けすべき物品の表面に記載されている仕分け先情報を可視像光学読取手段で光学的に読み取り、その可視像光学読取手段によって読み取られた仕分け先情報に基づいて、当該物品上に蛍光体を用いて仕分け先情報を印刷し、その印刷層の情報を潜像光学読取手段で光学的に読み取り、その潜像光学読取手段によって読み取られた仕分け先情報に基づいて物品を仕分けることを特徴とするものである。

【0096】第31の木発明は、前述の目的を達成するため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体を含有した検知用マークにおいて、記録すべきデータに対応した模様が形成されたデータ部と、そのデータ部に対する励起光の照射に先だって走査される部分に 形成された導入部とを備え、その導入部が、前記データ部において形成される模様の内で最も長い連続部分よりも十分長く連続することを特徴とするものである。

【0097】第32の本発明は、前述の目的を達成するため、前記第31の発明のマークの検出方法において、ほぼ一定強度の光を照射する光照射工程と、光の照射位置から放出される光を取り込むとともに、電気信号に変換する光電変換工程と、マーク中の前記導入部に対応する電気信号から比較値を自動的に設定する比較値設定工程と、マーク中の前記データ部に対応する検出値と前記比較値とを比べ、検出値が比較値を超えるとマークの形成位置であると判定するマーク判定工程とを備えたことを特徴とするものである。

【0098】第33の本発明は、前述の目的を達成するため、蛍光体を含有したマークに励起光を照射し、その40マークから発生される蛍光を受光することにより、マークを検出する方法において、ほぼ一定強度の励起光を断続的に照射する工程と、その励起光の照射位置から放出される光を入力して電気信号に変換する工程と、光照射期間中における入射光の大きさに対応する電気信号を比較値として取り出す入射強度検知工程と、入射光の蛍光成分に対応する大きさの電気信号を検出値として取り出す蛍光強度検知工程と、前記検出値と比較値とを比べ、検出値が比較値を上回るとマークの形成位置であると判定する判定工程とを備えたことを特徴とするものであ50

ていた。 【0099】第34の本発明は、前述の目的を達成するため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体を含有した検知用マークに励起光を照射し、マークから放出される蛍光を検知してマークを検出する光学 読取装置において、強度がほぼ一定の前記励起光を、所定の周期をもって継続させながら照射する光照射手段 と、前記励起光の照射位置から放出される光を取り込んで電気信号に変換する光電変換手段と、前記光照射手段の照射タイミングと同期させ、照射開始直前に対応する 最低値と、照射停止直前に対応する最大値と、照射停止 直後の検出値とを個別に検知可能とする波形検出手段 と、前記最大値と最低値の差を分圧した比較値と前記検 出値とを比べ、検出値が比較値を超えるとマークの形成 位置と判定するマーク判定手段とを備えたことを特徴と

【0100】第35の本発明は、前述の目的を達成するため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する蛍光体を含有した検知用マークに励起光を照射し、マークから放出される蛍光を検知してマークを検出する光学読取装置において、強度がほぼ一定の前記励起光を、所定の周期をもって継続させながら照射する光照射手段と、前記励起光の照射位置から放出される光を入力して電気信号に変換する光電変換手段と、前記光照射手段による照射期間と90度位相がずれたタイミングで同期をとりながら、前記光電変換手段からの出力信号の半分を反転増幅する波形整形手段と、その波形整形手段による出力信号から直流成分を選択的に取り出す低域通過型沪波手段とを備えたことを特徴とするものである。

するものである。

【0101】第36の本発明は、前述の目的を達成する 30 ため、照射した励起光に対して異なる波長の光を発する 蛍光体を含有した検知用マークに励起光を照射し、マー クから放出される蛍光を検知してマークを検出する光学 読取装置において、強度がほぼ一定の前記励起光を、所 定の周期をもって継続させながら照射する光照射手段 と、前記励起光の照射位置から放出される光から、蛍光 の波長成分の光を選択的に取り込む沪波手段と、その沪 波手段を介して取り込まれた光を電気信号に変換する光 電変換手段と、前記光照射手段の照射期間と90度位相 がずれたタイミングで同期をとりながら、前記光電変換 手段からの出力信号の半分を反転増幅する波形整形手段 と、その波形整形手段による出力信号から直流成分を選 択的に取り出す低域通過型沪波手段と、その低域通過型 沪波手段から出力される検出電圧を設定電圧と比較し、 検出電圧が設定電圧を超えると所定の検知信号を出力す る比較手段とを備えたことを特徴とするものである。

【0102】第37の本発明は、前述の目的を達成するため、蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍光体の励起光を照射する投光部と、前記蛍光体から発す 50 る蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号 に変換する受光部と、その受光部から出力される電気信 号を増幅する増幅部と、その増幅部の出力信号から前記 潜像によって記録された情報を検出する信号検出部とを 備えた光学読取装置において、前記増幅部の増幅率を前 記受光部に入射する前記反射光の強度に応じて切り換え 可能に構成し、ピーク値が予め定められた所定値以下の 当該増幅部の出力信号を前記信号検出部に取り込んでA /D変換し、前記潜像の形成パターンに対応する2値化 信号を得るように構成されていることを特徴とするもの である。

【0103】第38の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍 光体の励起光を照射する投光部と、前記蛍光体から発す る蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号 に変換する受光部と、その受光部から出力される電気信 号を増幅する増幅部と、その増幅部の出力信号から前記 潜像によって記録された情報を検出する信号検出部とを 備えた光学読取装置において、前記増幅部の増幅率を前 記受光部に入射する前記反射光の強度及び前記蛍光の強 度に応じて切り換え可能に構成し、ピーク値が予め定め 20 られた所定値以下の当該増幅部の出力信号を前記信号検 出部に取り込んでA/D変換し、前記潜像の形成パター ンに対応する2値化信号を得るように構成されているこ とを特徴とするものである。

【0104】第39の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍 光体の励起光を照射する投光部と、前記蛍光体から発す る蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号 に変換する受光部と、その受光部から出力される電気信 号を増幅する増幅部と、その増幅部の出力信号から前記 30 潜像によって記録された情報を検出する信号検出部とを 備えた光学説取装置において、前記増幅部の出力信号を 前記信号検出部に取り込み、その信号検出部で前記増幅 部の出力信号を2以上のスライスレベルを有する2以上 のスライス信号でスライスし、得られた2以上の2値化 信号の論理和をとることにより、前記潜像に対応する2 値化信号を得るように構成されていることを特徴とする ものである。

【0105】第40の本発明は、前述の目的を達成する ため、蛍光体を含む潜像が形成されたワークに、前記蛍 40 光体の励起光を照射する投光部と、前記蛍光体から発す る蛍光及び前記ワークからの反射光を受光して電気信号 に変換する受光部と、その受光部から出力される電気信 号を増幅する増幅部と、その増幅部の出力信号から前記 潜像によって記録された情報を検出する信号検出部とを 備えた光学読取装置において、前記信号検出部に、増幅 率が低い値に設定されているときの前記増幅部の出力信 号と、増福率が高い値に設定されているときの前記増幅 部の出力信号とを取り込み、その信号検出部で前記増幅 部の出力信号を特定のスライスレベルを有する1つのス 50 ントラキノン系、ジチオール金属系、フタロシアニン

32

ライス信号でスライスし、これにより得られた2以上の 2値化信号の論理和をとることによって、前記潜像に対 応する2値化信号を得るように構成されていることを特 徴とするものである。

[0106]

【作用】前記第1、第9、第14の本発明は、蛍光体の 平均粒子サイズが当該蛍光体から発する蛍光の最高強度 波長より小さい極微粒子状の蛍光体であるから、換言す れば発する蛍光波長の方が粒子より大きいから、蛍光体 子を越えて印刷層表面に到達する。そのため蛍光を有効 に放射することができ、蛍光の検出が確実であり、信頼 性の向上が図れる。

【0107】前記第2、第10、第15の本発明は、蛍 光体の平均粒子サイズが励起光の最高強度波長より小さ い極微粒子状の蛍光体であるから、換言すれば励起光波 長の方が粒子より大きいから、上方に蛍光体微粒子があ ってもそれを越えて下方の蛍光体粒子まで照射する。そ のため蛍光体の活性効率(励起効率)が高く、結果的に は蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。

【0108】前記第3の本発明は、蛍光体が前記一般式 (1)、(2)に示すように、光学活性元素としてN d, Yb, Erのいずれか1種以上の元素を含む含酸素 酸塩化合物からなる。この蛍光体も微粒子状のもので、 結果的には蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図 ns.

【0109】前記第4の本発明は、蛍光体が前記一般式 (3)、(4)、(5)に示すように、光学活性元素と してFeとErを有し、その光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, La のグループから選択された少なくとも1種の元素を含有 している。

【0110】この蛍光体も、従来の蛍光体とは異なった 発光スペクトルを有する新規な蛍光体であり、特にセキ ュリティが要求される分野において好適である。

【0111】前記第5の本発明は、蛍光体が前記一般式 (6)、(7)、(8)に示すように、光学活性元素と してYbを有し、その光学活性元素の他にSc, Ga, Al. In. Y. Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグル ープから選択された少なくとも1種の元素を含有してい る。

【0112】この蛍光体も、従来の蛍光体とは異なった 発光スペクトルを有する新規な蛍光体であり、特にセキ ュリティが要求される分野において好適である。またこ の蛍光体は大きさがほぼ揃っており、針状のものはほと んどなく丸みを有しており、組成物中での分散性が良好 である。

【0113】前記第6、第11の本発明は、蛍光体が赤 外線に対して吸収特性を有する例えばポリメチン系、ア

持させたNb, Yb、Erのグループから選択された1

種以上の希土類含有有機物から構成されることにより、 前記希土類が高速で読み取るに充分な蛍光出力を有し、 かつ様々な励起波長により発光することができる。

【0114】すなわち、Nb、Yb、Erのグループか ら選択された1種以上を含有する蛍光体はそれぞれの成

分で吸収および発光するが、希土類金属は一般に有機化 合物に比較して光の吸収効率が低いため、赤外領域に吸 収特性を有する有機化合物を加えて光の吸収効率を高く 10

することにより、希土類金属の発光強度をより向上させ ることができる。

【0115】また、担持させる有機物によって励起波長 が異なることから、蛍光体へ照射する励起波長を種々変 えることができる。

【0116】前記第7、第12、第13の本発明は、蛍 光体が前記一般式(9),(10)に示すように、光学 活性元素として少なくともNbまたYbを有し、その光 学活性元素の他にMoまたはWの少なくとも1種の酸化 物と、アルカリ土類金属とを含有している。

【0117】この蛍光体が、優れた耐水性を有する理由 については、次のように考えられる。即ち、水に対する 溶解度は、材料のアニオンとカチオンの結合が切れて、 イオンが水和物になるために必要なエネルギーの大小、 つまりアニオンとカチオンの結合力の大小で決まるので あるが、その結合力はイオンの荷数と配位数が関与して いる。従って同じアニオンを持つ塩で比較した場合、カ チオンとしては1価のアルカリ金属より2価のアルカリ 土類金属の方が結合力は強い。また、例えばアニオンを MoO42- としたとき、Naは6配位、Caは8配位と 30 なり、CaMoO,の方がNa, MoO,より結合力が 強い。

【0118】よって、同じアニオンに対しては、アルカ リ土類金属をカチオンとした方が耐水性に関しては有利 であり、希土類元素を付活した場合もその傾向は維持さ れているものと考えられる。

【0119】前記第8の本発明は、前記T2 RO4 · n H2 Oで示される塩を含むフラックス材料に、Ndまた はYbの少なくとも1種の光学活性元素と、Moまたは Wの少なくとも1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを 40 入れて焼成した後、前記フラックス材料を溶剤で溶解し て除去することを特徴とするものである。

【0120】この焼成によって作製される蛍光体の粒子 サイズについては、従来品のようにNa2 MoO4 を母 材として、焼成後に機械粉砕することによって粉末化し た蛍光体と、本発明のようにCaMoO4 を母材として 焼成後に粉砕することによって粉末化した蛍光体と、さ らに焼成時に水溶性のフラックス材料を導入し、焼成後 に水洗によってフラックスを除去した蛍光体とで粒子サ イズを比較すると、従来品では細かいもので約5μmの 50 遷移がある程度許容となる。この許容度は、結晶場の対

粒になっているのに対して、本発明品では約2~5 µm の1次粒子が2次凝集した微細粒子になっており、さら にフラックスを導入したものは1µm以下の超微細粒子 になっている。

34

【0121】焼成による固相反応において、反応生成物 (この場合は蛍光体)の粒子サイズを決める要因の一つ は出発原料の粒子サイズである。原料の粒子サイズが小 さいほど、反応生成物の粒子サイズは小さくなる。した がって、原料にはできるだけ粒子サイズの小さいものを 選ぶべきである。

【0122】粒子サイズを決めるもう一つの要因は、固 相反応を起こす原料間の接触面積である。この接触面積 が大きいほど、固相反応の起こる機会が増え、粒成長は 促進される。

【0123】例えば本発明品のCaMoO4 母材のみの 反応を考えた場合、固相反応は、

 $C a C O_3(s) + M o O_3(s) \rightarrow C a M o O_4(s) + C O_2(g)$ となる。(この場合、焼成温度は750℃であり、Ca CO3 の分解温度である900℃より低いが、若干分解 20 してCaCO₃(s)→CaO(s) +CO₃(g)のような反応 が起こっている可能性はある。)

フラックス材料として焼成温度の750℃よりも低い温 度の687℃に融点があるNa2 MoO4 を用いると、 固相反応を起こす。CaCO3とMoO3は、溶融した フラックス中に分散されて、原料間の接触面積が下が る。このことにより粒成長は妨げられ、反応生成物の粒 径は小さくなると考えられる。

【0124】発光強度については、例えばNdとYb共 付活の蛍光体の場合、従来品のNa2 MoO4 を母材と した蛍光体と、本発明品のCaMoO。を母材とした蛍 光体と、さらに粒子サイズを1μm以下にした蛍光体と を、パルス光励起に対する発光出力で比較すると、従来 品に対して本発明品は約80%、粒子サイズ1μm以下 では約40%と低くなっている。

【0125】しかしながらこれらの発光強度でも、Si 光検出器の感度を考慮した場合、実用上なんら問題はな い。この発光強度の低下は、蛍光体の粒子サイズが従来 品に対して小さいことに起因するものであり、母体材料 の種類に起因するものではないからである。また、応答 速度については、本発明品は従来品に対して同等以上で ある。

【0126】発光強度及び応答速度は、希土類元素の遷 移確率が関係しており、遷移確率が大きいほど相対的に 発光強度は高く、応答速度は速い。ところが、ここで光 学活性元素として用いているNd及びYbにおける光学 - 遷移は、f電子によるエネルギー準位間の遷移であり、 波動関数の偶奇性からこれは禁制遷移である。

【0127】しかしながら結晶中においては、結晶場に よってf軌道と逆の偶奇性をもつ準位が混ざり、f-f

称性が低いほど大きく、従って遷移確率も高い。例えば 従来品のNa2 MO4 は立方晶系であるのに対して、本 発明のCaMO, は正方晶系であり、結晶の対称性は低 い。よって、材料的にみて本発明品が従来品に比べて、 発光強度及び応答速度が劣ることはない。

【0128】また応答速度は粒径には依存せず、遷移確 率が高いと考えられる本発明品の方が若干速くなってい る。

【0129】前記第16の本発明は、印刷層中の蛍光体 粒子の含有率が1重量%を超えて30重量%未満である 10 ことから、印刷層の存在が目立たず、そのために潜像形 成部材の外観を損ねたりすることがなく、セキュリティ を付与するものに好適である。

【0130】前記第17の本発明は、印刷層の厚さを蛍 光休粒子の粒子サイズの35倍以内に規制することによ り、印刷層の存在が目立たず、そのために潜像形成部材 の外観を損ねたりすることがなく、セキュリティを付与 するものに好適である。

【0131】前記第18の本発明は、蛍光体微粒子を分 散、保持するためのバインダとして、励起光ならびに蛍 20 の搬送が可能となり、スリツト部材の損傷が防止でき 光に対する光透過率が80%以上のものを使用するか ら、印刷層への励起光の進入ならびに印刷層内で発した 蛍光の外部への放射が効率的に行われる。そのため、蛍 光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。

【0132】前記第19の本発明は、蛍光体粒子が例え ば紙などの微細な凹凸を有する繊維集合体上に付着して おり、結局、印刷層表面に微細な凹凸が形成される。蛍 光体粒子を含む印刷層を例えば合成樹脂フィルムなどの ような平滑な面上に形成すると、印刷層表面も平滑とな 正反射して、蛍光体の活性化に関与しなくなるが、この 発明のように蛍光体粒子を繊維集合体上に付着すれば励 起光の正反射がほとんどなく、蛍光体の励起効率が高 11.

【0133】前記第20の本発明は、印刷層の可視光吸 収率が20%以下であるから、印刷層はほとんど無色、 透明に近く、そのために潜像形成部材の外観を損ねたり することがなく、セキュリティを付与するものに好適で ある。

【0134】前記第21の本発明は、ミラーの一部に発 40 光素子からの励起光をほとんどすべて透過する透光部を 設けることにより、従来のハーフミラーを使用するもの に比較して、蛍光体への励起光量を増加することがで き、蛍光体の活性が効果的に行われる。

【0135】さらにミラーによる蛍光の反射量が従来の ハーフミラーを使用するものに比較して多い。そのた め、蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。 【0136】前記第22の本発明は、発光素子から照射 される励起光の放射パターンがバーコードの長手方向に 長い楕円形になっているため、従来の円形の放射パター 50

ンに比較して(即ち、円形放射パターンの直径と楕円形 放射パターンの短軸を同寸とした場合) に照射面積が増 大する。そのため発光強度が大となり、蛍光の検出が確 実であり、信頼性の向上が図れる。

36

【0137】前記第23の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度vが、スリット部材のスリット開口長さdと、蛍 光体の立ち上がり時間t』との関係で規制されているた め、読み取るべき情報 (例えば1本のバーコード) だけ を確実に、かつ時間的に無駄なく読み取ることができ る。そのため読み取りの信頼性を向上するとともに、高 速読み取りが可能となる。

【0138】前記第24の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度∨が、蛍光体を印刷した部分、例えばバーの間隔 しと、蛍光体の立ち下がり時間も。との関係で規制され ているため、隣のバーの残光の影響がなく読み取るべき 情報だけを確実に読み取り、信頼性が向上する。

【0139】前記第25の本発明は、第2の凸レンズと 受光索子との間にスリット部材を配置することにより、 潜像形成部材の厚さがある程度変更しても潜像形成部材

【0140】前記第26の本発明は、発光素子として集 光性ならびに指向性に優れた半導体レーザダイオードを 用い、それの駆動回路としてオートマチックパワーコン トロール機能を備えた回路を使用して、励起光をモニタ しながら励起光の出力状態を制御しているため、励起光 のパルス間隔ならびにパルス強度が一定しており、安定 した光学読取装置が提供できる。

【0141】前記第27の本発明は、潜像形成部材の搬 る。この平滑な印刷層に励起光を照射するとその一部が 30 送速度vと、スリット部材のスリット開口長さdと、蛍 光体の立ち上がり時間t゚との関係が規定されているた め、読み取るべき情報だけを確実に、かつ時間的に無駄 なく読み取ることができ、高速読み取りシステムが提供 できる.

> 【0142】前記第28の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度vと、蛍光体を印刷した部分、例えばバーの間隔 I.と、蛍光体の立ち下がり時間 t.a との関係が規定され ているため、隣のバーの残光の影響がなく読み取るべき 情報だけを確実に読み取り、信頼性の高い読み取りシス テムが提供できる。

> 【0143】前記第29、30の本発明は前述のような 構成になっており、物品の仕分けが自動的に効率よくか つ確実に行われる。

> 【0144】前記第31、32の本発明は、マークにお ける導入部の長さをデータ部の連続部分より十分長く設 定しているため、その導入部から発っせられる蛍光の強 度はデータ部に比較して十分に大きく且つ安定した状態 であり、その検知条件ないしは環境に対応した強さを呈 する.

【0145】更に、導入部はデータ部の走査開始位置の

直近に連続して設けられているため、データ部と一体になってデータ部の全域に亘ってそのコントラストを略一定に維持するように働き、データ部から放出される蛍光 の強さもその全域に亘って均一に変化する。

【0146】そこで、導入部における蛍光の強度を先ず 検出し、その値を基準としてデータ部から発生される蛍 光の強度を比較することにより、データ部に形成された マーク内容が正確に判定できる。

【0147】前記第33、34の本発明は、光照射手段からマークに対して光を照射すると、そのマーク上にお 10 ける光照射位置からは反射光に加えて所定波長の蛍光が発生する。この反射光と蛍光とを含む入射光は、光学的 戸波手段によって蛍光と同一波長の光が選択的に取り込まれたあと、光電変換手段により電気信号に変換され、波形検出手段で更に信号処理が行われる。

【0148】波形検出手段では、入射光の振幅の大きさと蛍光の大きさとが個別に検出される。そこで入射光の強さに対応して変化する比較値を作成し、その比較値と検出値とを次のマーク判定手段において比較することにより、入射光それ自体の強弱変化に対応して比較値は自 20動的に最適値に設定される。

【0149】更に、信号入力判定手段において入射光の大きさを常時判定し、有為な入射光が検出されたときにのみマーク判定手段における判定動作を開始させることにより、真正のデータのみが検出値と比較値として使用されるので、信頼性の向上が図れる。

【0150】前記第35、36の本発明は、光照射手段から所定のタイミングで断続する光をマークに照射すると、光の照射位置から光学的戸波手段に対して光が入射される。その光の中には、その波長分布はランダムであるが強度は略一定レベルの外部光と、波長分布は特定されるが強度は矩形波状に変化する反射光と、反射光の波長とは異なる特定波長であるが強度は光の照射に対して増減しながら変化する蛍光とが含まれる。

【0151】そこで、蛍光の波長の光を選択的に通過させる光学的沪波手段を用い、入射光中から蛍光以外の光成分を可及的に減衰させたあと、光電変換手段により光の強度を電気信号の強弱に変換する。

【0152】ここで、外部光の強度は略一定であり、反射光の強度自体は一定であるが周期的に断続する。一方、蛍光の成分は、図56(e)の実線で例示する如く、照射光に従って反射光と同一タイミングでその強度を増減させながら変化する。すなわち、蛍光の強度は、照射光のオフ時点の前後が発光および残光ともに最も強く、オン時点の前後が最も弱い。

【0153】そこで波形整形手段において、照射光の光 照射時期とタイミングをとりながら、光の照射期間と9 0度位相がずれたタイミングでその期間の入力信号を反 転増幅することにより、図56(f)のように、例えば 発光および残光ともに強い半周期が正電圧の変化とし 38

て、弱い半周期が負電圧の変化として取り出される。 【0154】ところで、外部光と反射光の成分は正負ともに等しいのに対し、蛍光の成分は両者の差が最も大きくなるように信号を反転処理している。従って、次の低域通過型沪波手段を通過させることにより、外部光と反射光は共にキャンセルされるが、蛍光の成分が含まれていると、正負両信号の差が直流電圧として取り出される。そこでこの電圧を比較手段で設定値と比べ、有為な値であると判断されると、マーク位置を示すマーク信号を出力するのである。

【0155】前記第37ないし40の本発明において、アナログ再生信号のレベルや振幅は、潜像が形成される下地の物性によって大きく変動する。一方、このアナログ再生信号のレベルや振幅は、増幅部の増幅率を変更することによって適宜調整できる。そこで、増幅部の増幅率を受光部に入射する反射光の強度に応じて切り換え、アナログ再生信号のレベルを予め信号検出部に設定されたスライス信号レベルに合致させれば、下地の物性の如何に関係なく、常に一定レベルのスライス信号で所望の2値化信号を得ることができるので、各種の素材からなるワーク上に形成された潜像情報を、1台の読取装置にて高精度に読み取ることができる。

【0156】また、増幅部の増幅率を受光部に入射する 反射光の強度及び蛍光の強度に応じて多段階に切り換え ると、より高精度にアナログ再生信号のレベルをスライ ス信号のレベルに合致させることができるので、潜像信 号の読み取りをより高精度に行うことができる。

【0157】一方、1つのワーク上に形成された一連の 潜像から検出されるアナログ再生信号が部分的にレベル 変動を伴う場合には、前記第1及び第2の各手段によっ ては、潜像情報を正確に読み取ることができない。

【0158】そこで、信号検出部に取り込まれたアナログ再生信号を、そのレベル変動に応じた2以上のスライスレベルを有する2以上のスライス信号でスライスすると、各レベルごとのアナログ再生信号の2値化信号が得られる。これらの各レベルごとの2値化信号の論理和をとれば、全体のアナログ再生信号に対応する2値化信号が得られる。よって、1つのワーク上に形成された一連の潜像から検出されるアナログ再生信号が部分的にレベル変動を伴う場合にも、潜像情報を正確に読み取ることができる。

【0159】また、これと同様の場合において、アナログ再生信号を2以上のスライス信号でスライスするのではなく、アナログ再生信号の各レベルに応じてその増幅率を調整し、特定のスライスレベルを有する1つのスライス信号でアナログ再生信号をスライスすることによっても、各レベルごとのアナログ再生信号の2値化信号を得ることができ、それらの論理和をとることによって、全体のアナログ再生信号に対応する2値化信号を得られる。

【0160】例えば高レベルのアナログ再生信号につい ては、増幅率を低くして特定のスライス信号でアナログ 再生信号をスライスする。このときには、低レベルのア ナログ再生信号については、2値化がなされない。一 方、低レベルのアナログ再生信号については、増幅率を 高くして前記特定のスライス信号でアナログ再生信号を スライスする。このときには、高レベルのアナログ再生 信号については、2値化がなされない。よって、これら の各2値化信号の論理和をとることによって、全体のア ナログ再生信号に対応する2値化信号を得られる。

[0161]

【実施例】次に本発明の各実施例などを下記の項目に別 けて説明する。

- 1. 蛍光体ならびに蛍光体組成物。
- 2. 蛍光体組成物の印刷方法ならびに潜像形成部材。
- 3. 光学読取装置ならびに光学読取システム。
- 1. [蛍光体ならびに蛍光体組成物]

蛍光体組成物例1

光学活性元素として少なくともネオジウム (Nd)を含 む有機金属化合物、好ましくはネオジウム(Nd)とイ ッテルビウム(Yb)を含む有機金属化合物である。

【0162】この有機金属化合物中の有機物はカルボン 酸類、ケトン類、エーテル類、アミン類のグループから 選択された少なくとも1種の有機物である。

【0163】より具体的には、前記有機金属化合物とし て、桂皮酸ネオジム、桂皮酸ネオジム・イッテルビウム 複合塩、安息酸ネオジム・イッテルビウム複合塩、ナフ トエ酸ネオジム、ナフトエ酸ネオジム・イッテルビウム 複合塩のグループから選択された少なくとも1種の有機 金属化合物である。なかでも桂皮酸とNdおよびYbか 30 らなるカルボン酸複合塩が好適である。

【0164】NdとYbの含有モル分率は、後述する図 2の結果からNd:Yb=9.5:5~3:7の範囲で 適宜選択され、特に発光強度の点から9:1~5:5の 範囲が好ましい。

【0165】この蛍光体は、如何なる方法により合成し てもよいが、M. D. Taylorらが報告した水溶液 中でのイオン交換反応 [J. Inorg. Nucl. C hem., 30, 1503-1511 (1968)], あるいはP.N.Kapoorらが報告した非極性溶媒 40 中でのイソプロポキシドの離脱反応 [Synth. Re act. Inorg. Met. -Org. Chem., Vo1.17,507-523(1987)] により合 成するとよい。

【0166】この蛍光体は無機蛍光体とは異なり、分子 中に例えばカルボン酸、βージケトン、環状エーテル、 環状アミンなどの有機物を有しており、特にカルボン酸 の一種である桂皮酸が化学的安定性に優れているととも に、発光出力が他のものよりも大きいため好適である。 【0167】またこの蛍光体の平均一次粒子サイズは、

好都合なことに励起光である赤外線の最高強度波長(8) 10 nm)のおおよそ80%以下、その蛍光体から発す る光の最高強度波長(980nm)のおおよそ70%以 下である。この蛍光体は、無機蛍光体のような凝固な一 次粒子を形成しているのではなく、蛍光体の結晶に損傷 を与えることがないので、粉砕も容易であり、バインダ との分散時により細かくなる。そしてインクジェットプ リンタ用のインクを作る際に、バインダ中に安定して分 散し沈降することがなく、ノズル詰まりや液滴の噴射性 10 が低下するようなこともない。

40

【0168】蛍光体の具体的な製造例を示せば次の通り

【0169】桂皮酸1.24g(8.37mol)と水 酸化ナトリウム0.37g(8.37mol)を各々1 20m1のイオン交換水に撹拌しながら加えて桂皮酸ナ トリウム水溶液を得て、この水溶液を0.1N水酸ナト リウム水溶液でpH10に調整する。

【0170】これとは別に塩化ネオジウム6水和物0. 50g(1.39mol)と塩化イッテルビウム6水和 20 物0.54g(1.39mol)とを、50mlのイオ ン交換水に完全に溶解させる。この水溶液を前記桂皮酸 ナトリウム水溶液に室温で撹拌しながら添加していくと 沈澱生成物が得られる。

【0171】その後、0.1Nの塩酸で反応液をpH5 になるように調整し、2時間撹拌して、得られた沈澱生 成物をろ過、洗浄した後に120℃で5時間乾燥し、桂 皮酸ネオジウム・イッテルビウム(1/1)複合塩が得 られる。収量は1.62g(収率:93.1%)であっ た。

【0172】図1はGaA1As発光ダイオードを励起 源とした桂皮酸ネオジウム・イッテルビウム(1/1) 複合塩の発光スペクトル図で、980mm付近で最大ピ 一クを示している。

【0173】図2はNd/Ybのモル比と発光強度との 関係を示す特性図で、同図に示すようにNd/Ybのモ ル比は9.5/5~3/7、好ましくは9/1~5/5 で高い発光出力を有する。

【0174】桂皮酸ネオジウム・イッテルビウム複合塩 の平均粒子サイズはO.2μmで、励起光の最高強度波 長(0.81μm)の約25%、発する蛍光の最高強度 波長(0.98μm)の約20%であり、励起光の最高 強度波長ならびに蛍光の最高強度波長よりも非常に小さ い。前記製造例において桂皮酸を安息香酸に変えた以外 は同様の方法で安息香ネオジウム・イッテルビウム (1 /1)複合塩を作ることもでき、この蛍光体の平均粒子 サイズも励起光の最高強度波長ならびに発する蛍光の最 高強度波長よりも小さい。

【0175】また他に、桂皮酸ネオジム、ナフトエ酸ネ オジム、ナフトエ酸ネオジム・イッテムビウム複合塩、

50 安息酸ネオジムなどの有機金属化合物からなる極微粒子

状の蛍光体も同様に使用できる。

【0176】これらの蛍光体の励起光の最高強度波長ならびに蛍光の最高強度波長はおおよそ0.8μm(800nm)を越えているから、平均粒子サイズが0.8μm以下の蛍光体を使用すると、励起光の進入ならびに蛍光の放出が効果的に行われる。

【0177】図3は、励起光の照射状態と蛍光体の発光 状態とを示す特性図である。図中の(a)はGaA1A s発光ダイオードの照射状態を示しており、2000 μ secの間隔で断続的に励起光を照射している。

【0178】同図(b)は前述の製造例で得られた桂皮酸ネオジウム・イッテルビウム(1/1)複合塩の発光状態を示しており、励起光の照射を開始して発光強度が最高発光強度の90%に達するまでの立ち上がり時間 t が約100 μ secである。また、励起光の照射を停止して残光の発光強度が最高発光強度から80%減衰するまでの立ち下がり時間 t が約50 μ secであり、結局、立ち上がり時間 t ならびに立ち下がり時間 t がとしに200 μ sec以内で、非常に応答性に優れている。

【0179】同図(b)は蛍光体がLiNd_{0.5} Yb 0.5 P4 O_{12} の場合の発光状態を示しており、立ち上がり時間 t_u が約1300 μ secで、立ち下がり時間 t_d が約1000 μ secで、立ち上がり時間 t_u ならびに立ち下がり時間 t_d がともに200 μ secを大幅に越えている。

【0180】前述のように蛍光体の立ち上がり時間も。 が200µsec以内であると、励起光を照射して受光 素子が蛍光を受光するまでの時間が非常短く、従って蛍 光体による潜像の読み取りが高速にできる。

【0181】また図4に示すように、蛍光体を用いてバーコードなどの印刷層18を形成した潜像形成部材10を搬送しながら光学読取装置25で前記コード情報を読み取る際、光学読取装置25中の発光素子から照射された励起光60で印刷層18中の蛍光体を活性化せしめ、その印刷層18から発した蛍光61を光学読取装置25中の受光素子で受光して、前記コード情報の読み取りができる。

【0182】なお32はスリット部材で、後で詳しく説明するように所定の印刷層18のみに励起光60を照射 40して、それからの蛍光61のみを受光するために光路上に設けられている。

【0183】このときの潜像形成部材10の搬送速度を v、スリット部材32におけるスリット32aの搬送方 向の長さをd、蛍光体の立ち上がり時間をt』としたと き、

 $t_u \leq d/v$

の関係が成立するように構成すれば、搬送中の印刷層1 8の情報がスリット32aと対向している間に確実に読 み取ることができる。もし、蛍光体の立ち上がり時間も 42

u がd/vよりも長いと、印刷層18が十分な発光強度になっていないままスリット32aの下を通過することになり、従って受光素子の出力が弱く、信頼性に問題がある。その点、前述の式が成立するような立ち上がり時間tu を有する蛍光体を使用すれば、情報の読み取りが確実である。また前にも述べたが立ち上がり時間tu の知い蛍光体を使用することにより、潜像形成部材10の 搬送速度 v を上げて読み取りの高速化を図ることもできる。

- 10 【0184】さらに同図に示すように潜像形成部材10 の搬送方向における印刷層18 (例えばバー) の間隔を L、蛍光体の立ち下がり時間をta としたとき、 ta ≤L/v
 - の関係が成立するように構成すれば、コード情報の適正 な読み取りが可能となる。もし立ち下がり時間taが比 較的長い蛍光体、換言すれば残光時間の比較的長い蛍光 体を使用すると、搬送されて通過した1つ前の印刷層1 8からの残光も読み取ることになり、そのためコード情 報の適正な読み取りができない。
- 20 【0185】これに対して蛍光体の立ち下がり時間もるが図3(b)のように極めて短い蛍光体を使用すると、前述のような弊害はなく、コード情報の適正な読み取りが可能となり、しかもバーの間隔しを短くして、潜像形成領域を狭くすることも可能である。

【0186】この蛍光体の密度(ρ1)との間で、ρ1 /ρ2≤1.8の関係を満たす密度(ρ2)をもつ有機 バインダを使用することにより、インク中での蛍光体微 粒子の沈降が少なく、印刷層を形成した場合でも蛍光体 微粒子がバインダの被膜の奥深くに隠れてしまい、励起 30光が容易に到達しないという問題が排除できる。

【0187】印刷層中におけるバインダの含有率は、5 重量%以上必要である。それよりも少ないと蛍光体粒子 の脱落があり、そのためにバーコードなどの印刷が不完 全となり、適正な情報保持ができなくなる。このような ことから、バインダの含有率は5重量%以上必要であ る。

【0188】水溶性有機バインダとしては、例えばアクリル系樹脂および側鎖にエステル基またはポリエーテルを含有するアクリル樹脂などが使用される。この他、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロース、デンプン、ナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、ポリスチレンスルホン酸塩なども使用できる。

【0189】非水溶性有機パインダとしては、例えばノボラック型フェノール、レゾール型フェノール、ロジン 変性フェノール、アルキル変性フェノールなどのフェノール樹脂、水添化ロジン、およびそのポリエチレングリコールエステル、多価アルコールエステル、ロジングリセリンエステルなどのロジン樹脂などがある。

【0190】溶剤としては水、アルコール、ケトン、エ

ステル、エーテル、芳香族炭化水素系溶剤、脂肪族炭化 水素系溶剤などが単独あるいは混合して用いられる。

【0191】また、導電性付与剤としての電解質にはし i NO3 、LiCl、KCl、NaCl、KNO3 など が使用される。

【0192】安定化剤としては、アルキルフタレート (例えばジオクチルフタレート、ジブチルフタレートな ど)、アリルフタレート、グリコール(エチレングリコ ール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコー ル、ポリプロピレングリコールなど)、グリコールエス 10 な組成例を示せば次の通りである。 テルなどが単独もしくは混合して使用される。

【0193】消泡剤としては、シリコン系、シリカ・シ*

* リコン系、金属石鹸、アマイド系、ポリエーテル系など が使用される。

【0194】染料を併用することもできる。染料として は、ダイレクトブラックGW、キャパミンブラックES A、ローダミンB、ローダミン7G、メチレンブルー、 ダイレクトファーストオレンジ、コンプランチングリー ンG、ミーリングイエローO、カチオンピンクFGなど がある。

【0195】インクジェットプリンタ用インクの具体的

[0196]

桂皮酸ネオジウム・イッテルビウム複合塩 (平均粒子サイズ0. 2μm)

80重量部 フタロシアニンブルー 1重量部 カチオン系アクリル樹脂 20重量部 ポリエチレングリコール 1重量部 ジオクチルフタレート 0.5重量部 KC1 0.5重量部 消泡剤 0.4重量部 水 100重量部 エタノール 20重量部

この組成物をサンドミルで1時間混合分散して、インク ジェットプリンタ用インクを作成し、これを用いてイン クジェットプリンタで紙上に印字した。

【0197】印字の状態を観察したところ、インクの滲 み出しは見られず、高精度の青色の印字であった。

【0198】この印字を光学的に検出するため、波長9 70 n m付近に最高強度波長を有する光を照射して励起 し、シリコンフォトダイオード検出器で蛍光を受光し て、読み取り速度4m/secで読み取り試験を100 回行ったところ、100回とも印字情報を確実に検出す ることができた。

【0199】前記インク組成において、必要に応じてフ タロシアニンブルー、ポリエチレングリコール、ジオク チルフタレート、水、エタノールなどの添加量を増減し たり、省略したりすることができる。

【0200】前記組成表にも記載されているように、溶 剤に水を使用する場合に水ならびにそれと相溶性のある 例えばアルコールなどの易揮発性有機液体を併用する と、蛍光体組成物の乾燥が速く、例えば紙などの上に蛍 光体組成物を印刷するとき、それも特にインクジェット プリントのように溶剤量が多いときに効果的である。

【0201】前記インク組成において、カチオン系アク リル樹脂の添加量を種々変えて粘度の異なる多種類のイ ンクを調整し、そのインクの粘度と、液滴の大きさの変 化率ならびに印字した蛍光層の相対的な発光出力との関 係を調べて、その結果を図5に示した。

【0202】この図から明らかなように、インクジェッ トプリンタ用インクの粘度が2~25cps、好ましく※50 偏向制御が困難となり、印字が欠けたり、曲がったりし

※は10~20cpsの範囲にあると、液滴の大きさの変 化率が10%以下で均一な液滴が得られて印刷性に優 れ、しかも十分な発光出力が得られる。なお、インクジ ェットプリンタ用インクの粘度が25cpsを超える と、印字ノズルの詰まりなどが発生して、印字がしにく くなる。

【0203】前記インク組成において、エタノールの添 30 加量を種々変えて表面張力の異なる多種類のインクを調 整し、そのインクの表面張力と液滴の大きさの変化率と の関係を調べて、その結果を図6に示した。

【0204】この図から明らかなように、インクジェッ トプリンタ用インクの表面張力が23~40dyne/ cm、好ましくは26~37dyne/cmの範囲にあ ると、液滴の大きさの変化率が小さく、インクジェット プリンタに必要な均一な液滴が得られて印刷性に優れて いる。

【0205】前記インク組成において、電解質 (KC 40 1)の添加量を種々変えて比抵抗の異なる多種類のイン クを調整し、そのインクの比抵抗と液滴の大きさの変化 率との関係を調べて、その結果を図7に示した。

【0206】この図から明らかなように、インクジェッ トプリンタ用インクの比抵抗が2000Ωcm以下、好 ましくは1500Ωcm以下の範囲にあると、液滴の大 きさの変化率が小さく、インクジェットプリンタに必要 な均一な液滴が得られて印刷性に優れている。なお、イ ンクジェットプリンタ用インクの比抵抗が2000Ω c mを超えると、特に荷電偏向印字方式の場合には液滴の

て、印字品質の低下をきたす。

【0207】前記インク組成において、KC1の他にK OHの添加し、その添加量を種々変えてpHの異なる多 種類のインクを調整して、そのインクのpHと分散安定 性との関係を調べて、その結果を図8に示した。なお、 分散安定性は、得られたインクジェットプリンタ用イン クを一週間放置した後の上澄みのできかたを全体に対す る割合で表した。

【0208】この図から明らかなように、インクジェッ トプリンタ用インクのpHが4.5~10、好ましくは 10 た。 5~7の範囲にあると、インクの分散性ならびにその後 の安定性が非常に良好である。なお、インクジェットプ リンタ用インクのpHが4.5未満であったり、あるい は10を超えると、インク中の顔料などが凝集する傾向 にある。

【0209】このように本発明のインクジェットプリン タ用インクは、粘度を2~25cps、表面張力を23 ~40dyne/cm、比抵抗を2000Ωcm以下、 pHを4.5~10に規制することにより、分散安定性 が良好で、印刷時の滲み出しがなく、印刷性に優れ、発 20 な形状をしている。 光出力の大きいものが得られる。

【0210】蛍光体組成物例2

Nd, Yb, Erのいずれか1種以上の元素を含む含酸 素酸塩化合物からなる蛍光体。この含酸素酸塩化合物と しては、具体的にはバナジン酸塩化合物、リン酸塩化合 物、ホウ酸塩化合物、モリブデン酸塩化合物ならびにタ ングステン酸塩化合物などがあるが、その中でも特にリ ン酸塩化合物は耐薬品性に優れているため賞用できる。 【0211】より具体的には下記の一般式(1)、

(2)を有するリン酸塩からなる赤外発光蛍光体があ る.

【0212】一般式(1)

Lnx A1-x PO4

式中LnはNd、Yb、Erのグループから選択された 少なくとも1種の元素、AはY, La, Gd, Bi, C e、Lu、In、Tbのグループから選択された少なく とも1種の元素、Xは0.01~0.99の範囲の数

【0213】一般式(2)

DE1-x Lnx Py Oz

式中 DはLi, Na, K, Rb, Csのグループから 選択された少なくとも1種の元素、EはY, La, G d, Bi, Ce, Lu, In, Tbのグループから選択 された少なくとも1種の元素、LnはNd, Yb, Er のグループから選択された少なくとも1種の元素、Xは 0.01~0.99の範囲の数値、Yは1~5の範囲の 数値、Zは4~14の範囲の数値。

【0214】なお、一般式(2)のDは必ずしも必要で はない。また、一般式(2)中のX,Y,Zの値は現在 のところ明確には把握されておらず、おおよそ前述の範 50 【0225】さらに具体的には、下記のような赤外発光

囲であると推測される。

【0215】これら蛍光体の具体的な製造例(試料1~ 14)ならびに比較例(試料15)における仕込み原料 の割合と焼成時間、それによって製造された赤外発光蛍 光体の組成および粒子サイズを図9ないし図12に示 す。

46

【0216】図9、10に示す仕込み原料は各温度で2 時間焼成した後、熱水ならびに1モルの硝酸で処理して 未反応物質を除去することにより赤外発光蛍光体を得

【0217】図11、12から明らかなように本発明の 実施例で得られた蛍光体の粒子は比較例のもの(6 μ m) に比較して小さく $4\mu m$ 以下であり、中には $1\mu m$ 以下の極小の微粒子のものもあり、前述のように励起光 の最高強度波長ならびに (あるいは)発する蛍光の最高 強度波長よりも小さい物もある。

【0218】また蛍光体粒子を走査型電子顕微鏡で観察 してみると、粒子の形状ならびに大きさが全体的に揃っ ており、粒子形状は針状ではなく、河原の石ころのよう

【0219】本発明の実施例に係る試料1、試料7なら びに比較例である試料15の発光スペクトルをそれぞれ 図13、図14、図15に示す。図13に示す試料1の 場合は励起波長は0.81μm(810nm)、蛍光波 長は0.98 µm (980 nm) であるのに対して、平 均粒子サイズはO.6µmであるから、励起波長ならび に蛍光波長よりも小さい極小の微粒子である。図14に 示す試料7の場合は蛍光波長は1.59 μmであるのに 対して、平均粒子サイズは1.0 µmであるから、蛍光 30 波長よりも小さい極小の微粒子である。

【0220】蛍光体組成物を構成する他の例えばバイン ダーや溶剤などは蛍光体組成物1で述べたものと同様で あるので、それらの説明は省略する。

【0221】蛍光休組成物3

光学活性元素としてFeおよびErを含有し、他にS c, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグループから選択された少なくとも1種の元素を 含有した蛍光体を使用する。

【0222】より具体的には、下記の一般式(3)~ (5)を有する赤外発光蛍光体を使用する。

【0223】一般式(3) G3 J5 O12

一般式(4) GJO₃

一般式(5) G2 J4 O12

但し式中GはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグル ープから選択された少なくとも1種の元素と、Erから なり、JはSc, Ga, Al, Inのグループから選択 された少なくとも1種の元素と、Feからなる。

【0224】前記一般式(3)~(5)を有する蛍光体 が単独で、または混合物の形で使用される。

蛍光体である。

[0226] O. Ero. 2 Y2.8 Fe1.5 Al3.5 O12

- 2. Ero. 5 Y2. 5 Fe1. 5 Ga3. 5 O12
- 3. Ero. 2 Lu2.8 Fe2.5 Al3.5 O12
- @. Ero. 05 Lao. 95 Feo. 3 Alo. 7 O3
- 5. Ero. 02 Lao. 98 Feo. 1 Gao. 9 O3

つぎにこれら蛍光体の具体的な製造例について説明す

【0227】図16に示す重量(g)の仕込み原料を乳 熱水と2モルの硝酸により未反応物を取り除いて各々の 赤外発光蛍光体を得た。

【0228】前記試料16である(ErY)3 (FeA 1)5 O12の発光スペクトルを図17に示す。また、G eフォトダイオードの分光感度特性を図18に、InG aAsフォトダイオードの分光感度特性を図19に、そ れぞれ示す。

【0229】図17に示すようにEェを含有した蛍光体 の発光スペクトルのピークは約1540 nmにあり、こ れに対して図18に示すGeフォトダイオードならびに 20 図19に示すInGaAsフォトダイオードは、波長1 400~1600 nmの範囲で高い感度を有するから、 この種の受光素子として好適であり、読取速度を高速に してもバーコードパターンのような微細なマークの読み 取りが確実であるという特長を備えている。

【0230】なお、その他にPbSフォトダイオード (受光感度:約600~1800nm), PbSeフォ トダイオード(受光感度;約1000~4500nm) なども使用可能である。

【0231】前述のような吸収ならびに発光スペクトル 30 特性は、光学活性元素としてFeおよびErを含有した 他の赤外発光蛍光体においても同様に得られる。

【0232】蛍光体組成物4

光学活性元素としてYbを含有しており、この光学活性 元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd、Lu、Laのグループから選択された少なくとも 1種の元素を含くんだ蛍光体を使用する。

【0233】更に詳細には、下記の一般式(6)~ (8)を有する蛍光体を使用する。

【0234】一般式(6) L3 M5 O12

- 一般式(7) LMO₃
- 一般式(8) L2 M4 O12

但し式中LはY, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグル ープから選択された少なくとも1種の元素と、Ybから なり、MはSc, Ga, Al, Inのグループから選択 された少なくとも1種の元素からなる。

【0235】前記一般式(6)~(8)を有する蛍光体 が単独で、または混合物の形で使用される。

【0236】さらに具体的には、下記のような赤外発光 蛍光体である。

[0237]

- O. Ybo.3 Y2.7 A 15 O12 (試料21)
- ②. Ybo.2 Gd2.8 Gao.5 Al4.5 O12 (試料2 2)

48

- 3. Yb_{0.4} Y_{2.6} Ga₅ O₁₂ (試料23)
- Ø. Yb_{0.1} La_{0.9} AlO₃ (試料24)
- ⑤. Ybo.05 Lao.95 Gao.1 Alo.9 O3 (試料2

図20に示す重量(g)の仕込み原料を乳鉢で十分に混 鉢で十分に混合した後、図中の条件で焼成し、その後に 10 合した後、図中の条件で焼成し、その後に熱水と2モル の硝酸により未反応物を取り除いて各々の赤外発光蛍光 体を得た。

> 【0238】前記試料21であるYbo.3 Y2.7 Als O12の吸収発光スペクトルを図21に示す。

【0239】この図から明らかなようにこの蛍光体は、 910~950 nm付近で光吸収ピークを有し、その付 近の波長を有する光を照射することにより、蛍光体が励 起され、約1030nm付近にピークを有する蛍光を放 出する。

【0240】図22は、蛍光体Ybx Y1-x Als O12 中のYbのモル分率(X)の値を種々変えた場合の蛍光 体の発光強度の変化を測定した図である。

【0241】この図から明らかなように、蛍光体Ybx Y1-x A 15 O12中のYbのモル分率Xが0.7を超え ると発光強度は弱くなる傾向にあるから、モル分率Xは 0.05~0.7、好ましくは0.1~0.5、さらに 好ましくは0.2~0.45の範囲に規制すると、高い 発光強度が得られることが分かる。

【0242】前記Ybo.3 Y2.7 Als O12の粒子の表 面状態は走査型電子顕微鏡で観察してみるとギザギザが なく滑らかで、極端に大きい物や小さい物がなく形状な らびに大きさがほぼ揃っており、丸みを有し果実状をし ている。そして粒子サイズが1~3μmのものが全体の 60重量%以上(約80重量%)の粒度分布を有し、蛍 光体粒子の平均形状比率(短軸/長軸)が2.0以下で あって、極端に細長い針状のものはなく丸みのある物が 多く、バインダー中での分散性が良好である。

【0243】蛍光体組成物例5

例えば波長が700~1000 nmの範囲の赤外線に対 40 して吸収特性を有する有機物を担持させた、Nb. Y b、Erのグループから選択された1種以上の希十類含 有有機物からなる蛍光体を使用する。

【0244】具体的には前記有機物は、ポリメチン系、 アントラキノン系、ジチオール金属系、フタロシアニン 系、インドフェノール系、アゾ系色素のグループから選 択された1種以上の有機物である。

【0245】より具体的には、前記ポリメチン系色素と しては、例えばコダック・ラボラトリーズ・ケミカルズ 社製の商品名 [R-125、 [R-140、日本化薬社 50 製の商品名 IR-820 Bなどがある。アントラキノン

系色素としては、例えば日本化薬社製の商品名IR75 0などがある。ジチオール金属塩系色素としては、例え ば三井東圧社製の商品名テトラブチルホソホニウムビス (1、2-ベンゼンチオラート) ニコレート (川) など がある。フタロシアニン系色素としては、例えばZn-ナフタロシアニンなどがあり、他にインドフェノール系 色素やアゾ系色素が挙げられる。これらの中でも、単位 重量当りの発光強度が大きい点から前記商品名IR12 5、IR140、IR750およびIR820Bを用い るのがより好ましい。

49

【0246】このような赤外領域の光に対して吸収特性 を有する有機物を前記希土類に担持させることにより、 高速読み取り時の発光強度を希土類単体よりさらに増加 できる理由は以下によるものと考えられる。

【0247】即ち、赤外領域の光に対して吸収特性を持 つ有機物が吸収したエネルギーを基底状態に戻す過程 で、Nb、YbおよびErから選ばれた1種以上の希土 類含有有機物にトランスファーすることにより、これら 希土類の蛍光作用を増感するために起きる現象と考えら

【0248】この増感作用を有する有機物を担持するこ とができる蛍光体としては、Nb、YbおよびErのグ ループから選ばれた1種以上の希土類を有していれば良 く、他の元素が添加されてもなんら問題ない。

【0249】また、Nb、YbおよびErのグループか ら選ばれた1種以上の希土類含有有機物は、有機物とし て希土類と錯体あるいは塩を形成するものであれば如何 なるものでもよい。例えば安息香酸、アニス酸、トルイ ル酸、桂皮酸、ラウリン酸等の有機カルボン酸、ベンゾ トリフルオロアセトン、テノイルトリフルオロアセトン 30 等の8-ジケトン、15-クラウン-5、18-クラウ ンー6等の環状エーテル等が列挙できる。

【0250】これら中でも、担持させる有機物は殆ど芳 香環あるいは複素環を有しており、Nb, YbおよびE rのグループから選ばれた1種以上の希土類含有有機物 中の有機物が芳香族カルボン酸であれば、その有機物と Nb. Yb. Erから選ばれた1種以上の希土類との相 互作用がより強くなり、担持能力が一層増加する。

【0251】この希土類含有有機物の合成方法は、特に 限定されるものではないが、例えばNb, Yb, Erか 40 ら選ばれた1種以上の希土類含有芳香族カルボン酸の合 成は、前述したM.D.Taylorらが既に報告した 水溶液中でのイオン交換反応あるいはP. N. Kapo orらが報告した非極性溶媒中でのイソプロポキシドの 離脱反応により合成することが可能である。

【0252】赤外領域の光に対して吸収特性を持つ有機 物のNb, Yb, Erから選ばれた1種以上の希土類含 有有機物に対する量は、特に限定されないが0.001 ~10重量%が好ましい。有機物の含有率が0.001 重量%より少なければ励起光源の吸収率が低く、その結 50 については使用した有機物の励起波長に対応させて波長

果、希土類含有有機物の発光が弱くなる。一方、有機物 の含有率が10重量%より多ければ、赤外領域の範囲に 吸収特性を持つ有機物の濃度が高くなり、有機物どうし でエネルギーの交換を行うこととなり、その結果、希土 類含有有機物の発光が弱くなる。

【0253】この有機物を担持した赤外蛍光体をインク として用いる場合、バインダーとしては一般に使用する ものを用いることができるが、有機物の担持性の観点か ら、特にポリピニルアルコール (PVA) またはアクリ 10 ル樹脂が好ましい。

【0254】溶媒は必要に応じて使用しても良く、使用 できる溶剤としては水、アルコール類、ケトン類、エス テル類、エーテル類、芳香族炭化水素類、脂肪族炭化水 素類が単独もしくは混合して用いられる。

【0255】赤外蛍光体インク組成物を種々の印刷方式 で適用する場合に応じて、分散剤、消泡剤、界面活性 **剤、保湿剤および電導性付与剤等を用いても良い。さら** に必要に応じて、各種整色染料、蛍光染料等を併用して も良い。

【0256】蛍光体の具体的な製造例を示せば次の通り 20 である。

【0257】(実施例1)桂皮酸ネオジム・イッテルビ ウム複合塩1重量部を水20重量部に懸濁させ、撹拌し ながら、0.005重量部のアントラキノン系色素(日 本化薬社製 商品名 I R 7 5 0 吸収波長のピーク: 7 50nm)をDMF1重量部に溶かした溶液を滴加し、 1時間撹拌後に沪過、乾燥して赤外発光蛍光体を得た。 【0258】(実施例2)桂皮酸イッテルビウム1重量

部を水20重量部に懸濁させ、撹拌しながら、0.00 3 重量部のポリメチン系色素 (日本化薬社製 商品名 I R-820B吸収波長のピーク:820nm)をDMF 1重量部に溶かした溶液を滴加し、1時間撹拌後に沪 過、乾燥して赤外発光蛍光体を得た。

【0259】(実施例3)安息香酸イッテルビウム1重 量部を水20重量部に懸濁させ、撹拌しながら、0.0 03重量部のポリメチン系色素(日本化薬社製 商品名 IR820B 吸収波長のピーク:820nm)をDM F1重量部に溶かした溶液を滴加し、1時間撹拌後にデ 過、乾燥して赤外発光蛍光体を得た。

【0260】(比較例1)LiNdo.5 Ybo.5 P4 O 12をボールミルで粉砕して赤外発光蛍光体を得た。

【0261】(比較例2)前記実施例1でアントラキノ ン系色素(商品名 IR750)を使用しなかった以外 は、実施例1と同様にして赤外発光蛍光体を得た。

【0262】《高速読取試験》前記実施例1~3および 比較例1、2で得られた赤外発光蛍光体を、各々直径5 mm、厚み2mmの円盤状に成形した。高速読取試験方 法は、試料を8m/secの速度で走査して、市販品の GaAlAs発光ダイオードで、実施例1~3の蛍光体

の異なる励起光を照射し、970 nmの発光を検知する *示す。 Si-PIN光検出器で検出した。なお、検出器の前に 光学フィルター(富士写真フィルム社製 商品名 I Rー 94)を置いた。この高速読取試験の結果、次に表1に*

[0263] 【表1】

【表 / 】

	助起波長 (nm)	相対強度(%)		
実施例(760	700		
实施例 2	800	650		
実施例3 .	760	800		
比较例!	800	検出不能		
比較例 2	800	100		

【0264】次に、蛍光体とパインダーを用いて常法に ※【0265】(実施例4) より、インクを作製した。

桂皮酸ネオジム・イッテルビウム複合塩

1重量部

アントラキノン系色素(商品名 IR750)

0.005重量部

PVA

4重量部

水/EtOH(8/2)

20重量部

この組成のものをボールミルで24時間分散してインク 潜像を印刷により形成した。

【0266】(比較例3)前記実施例4において桂皮酸 ネオジム・イッテルビウム複合塩を使用しない以外は同 様の方法で潜像を形成した。

★【0267】(比較例4)前記実施例4においてアント を作製し、これをインクジェットプリンターに装填して 30 ラキノン系色素 (商品名 IR750)を使用しない以 外は同様の方法で潜像を形成した。但し、励起波長を7 60nmの場合を(a)、800nmの場合を(b)と した。

【0268】(実施例5)

桂皮酸イッテルビウム

1重量部

ポリメチン系色素(商品名 IR820)

0.003重量部

PVA

4重量部

水/EtOH(8/2)

20重景部

この組成のものをボールミルで24時間分散してインク 潜像を印刷により形成した。

☆同様の方法で潜像を形成した。 を作製し、これをインクジェットプリンターに装填して 40 【0270】(比較例6)前記実施例5において桂皮酸 イッテルビウムを使用しない以外は同様の方法で潜像を 形成した。

【0269】(比較例5)前記実施例5においてポリメ チン系色素(商品名 IR820)を使用しない以外は☆

【0271】(実施例6)

安息香酸イッテルビウム

1 重量部

ポリメチン系色素(商品名 IR820)

0.005重量部 4 重量部

PVA

水/EtOH(8/2)

20重量部

この組成のものをボールミルで24時間分散してインク を作製し、これをインクジェットプリンターに装填して 潜像を印刷により形成した。

◆【0272】(比較例7)前記実施例6においてポリメ チン系色素(商品名 IR820)を使用しない以外は ◆50 同様の方法で潜像を形成した。

【0273】(比較例8)前記実施例6において安息香 酸イッテルビウムを使用しない以外は同様の方法で潜像 を形成した。

【0274】《高速説取試験》前記実施例4~6および 比較例3~7で得られた印刷物の高速読取試験を行っ た。高速読取試験方法は、各試料を8m/secの速度 で走査して、市販品のGaAlAs発光ダイオードで、 実施例4~6、比較例3、6及び8の印刷物については* * 使用した有機物の励起波長に対応させて波長の異なる励 起光を照射し、970mmの発光を検知するSi-PI N光検出器で検出した。但し、検出器の前に光学フィル ター(富士写真フィルム製 商品名IR-94)を置い た。その高速読取試験の結果を次の表2に示す。

54

[0275]

【表2】

【表 2 】

		聯起波長(nm)	相対強度(火)	
実施例 4		760	100	
实施例 5		800	100	
实施例 6		800	120	
比較何多		760	30	
比較何4	(a)	760	検出不能	
	(b)	800	40	
比較例 5		800	20	
比較例 6		800	10	
比較例ア		800	10	
比较例8		800	40	

【0276】前記表1ならびに表2から明かなように、 実施例1~3で得られた蛍光体は、比較例1、2で得ら れた蛍光体に比較し、高速読み取りにおいて充分な発光 40 の原子比率 tは0 < t ≤ 3 であることが望ましい。 出力が得られる。また、実施例1~3で得られた蛍光体 は、様々な励起波長により発光することができる。

【0277】前記実施例4~6で得られたインクは、イ ンクジェットプリンター用に好適である。

【0278】蛍光体組成物例6

光学活性元素としてNdまたはYbの少なくとも1種 と、MoまたはWの少なくとも1種の酸化物と、アルカ リ土類金属とで構成された塩を母体材料とすることによ り、蛍光体の耐水性を高めたものである。

【0279】MoまたはWの少なくとも1種の酸化物に※50

※対する光学活性元素の原子比率sは0<s≤2とするの が好ましく、また前記酸化物に対するアルカリ土類金属

【0280】より具体的には、その蛍光体は次の一般式 (9)を有する化合物である。

一般式(9)

(Ndi-x Ybx) y Qz (RO4)

式中QはCa、Mg、Sr、Baのグループから選択さ れた少なくとも1種の元素、RはMo, Wのグループか ら選択された少なくとも1種の元素、Xは0~1の範囲 の数値、Yは0を超え1未満の数値、2は0を超え1以 下の数値。

【0281】またはその蛍光体は、次の一般式(10)

を有する化合物である。 一般式(10)

(Nd1-x Ybx) 24 Q8-34 (RO4) 8

式中QはCa, Mg, Sr, Baのグループから選択さ れた少なくとも1種の元素、RはMo、Wのグループか ら選択された少なくとも1種の元素、Xは0~1の範囲 の数値、Yは0を超え8/3の範囲の数値。

【0282】なお式中のX及びYの値は、それぞれ0. 02≦X≦0.6及び1/3≦Y≦5/3の範囲とする 光中心のYb濃度が低くなり、Xの値がO.6を超える。 と励起光を吸収する増感材のNd濃度が低くなり、何れ も発光強度が低下する場合がある。また、Yの値が1/ 3未満では光学活性元素であるるNd, Yb 濃度が低く なり、Yの値が5/3を超えるとNd、Yb濃度が高く なり濃度消光を起こし、発光強度が低下する場合もあ る.

【0283】アルカリ土類金属としてはCa、Mg、S r, Baが挙げられるが、中でもCaが望ましい。この アルカリ金属元素の含有率は、10原子%以下に規制す 20 るのが望ましい。また、式中のRとして特にMoを用い ることが望ましい。

【0284】この蛍光体の製造にあたっては、Ndまた はYbの少なくとも1種の光学活性元素と、Moまたは Wの少なくとも1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを 混合し、これをT2 RO4 · nH2 O (ただしTはL i, Na, Kのグループから選択された少なくとも1種 の元素、RはMo,Wのグループから選択された少なく とも1種の元素、nは0以上の数値)で示される塩を含 むフラックス材料に入れて、これを焼成した後にフラッ 30 クス材料を溶剤で溶解して除去することにより、粒子サ イズを極微細化することができる。

【0285】フラックス材料のTとしてはとりわけNa が、またフラックス材料のRとしてはMoが望ましい。 【0286】フラックス材料の蛍光体材料に対する混合 モル比は1以上10以下とすればよい。混合モル比が1 未満ではフラックス材料としての効果が低く、赤外発光 蛍光体の粒径を微細化しにくいし、逆に混合モル比が1 0を超えると材料費やるつぼの大きさなどで、コストが 高くなる。

【0287】この方法で得られた蛍光体は、平均粒子サ イズが1μm以下の極微細粒子で、インクジェットプリ ンターやインクリボン等の印刷法にも適する。

【0288】この蛍光体の特質としては、励起光の照射 を止めた後の残光が発光出力の10%になるまでの時間 が500µsec以内であり、1msec周期のパルス 光励起で発光を識別したり、0.5m/sec以上の走 行速度で発光を識別するシステムに好適である。

【0289】またこの蛍光体は、水に20時間浸漬した 時の水に対する溶解度が2重量%以下であるという優れ 50 を24モル採取して、これを充分に混合粉砕し、アルミ

た耐水性を有している。

【0290】このような蛍光体は、これを分散、保持す る透明なバインダーに分散させたインクをテープ状基材 に塗布することによって、容易に熱転写インクリボンに することもでき、またインクジェットプリンター用のイ ンクとして用いることもできる。さらにこの蛍光体は優 れた耐水性を有することから、塗料として利用すること もできる。

56

【0291】前記パインダーとしては、ワックス、塩化 のが望ましい、Xの値がO. O2未満では発光を担う発 10 ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル共 重合体、ポリエステル、ポリウレタン、カーボネート等 の樹脂が使用できる。また、必要に応じて可塑剤、界面 活性剤などを適宜添加してもよい。

【0292】この蛍光体の耐水性について本発明者らが 実験によって確認したところによれば、例えば母体材料 のアニオンがMoO42- である場合、従来品のようにカ チオンをアルカリ金属であるNa⁺ とした母材Na₂ M ○○4 に希土類元素を付活した蛍光体と、本発明のよう にカチオンをアルカリ土類金属であるCa2;とした母材 CaMoOf に希土類元素を付活した蛍光体とで、水に 対する溶解度を比較すると、従来品ではわずか20時間 程度水に浸漬させただけで蛍光体の約10重量%が溶解 するのに対して、本発明品では500時間浸漬後もほと んど溶解しないという優れた耐水性を有している。

【0293】次に具体例について説明する。

(1)粉末原料の作製

次に示す要領で10種類の蛍光体を作製し、粉末の粒子 の形態、平均粒子サイズ (平均粒径)、蛍光体の発光波 長、励起光を止めた後の残光が発光出力の10%になる までの残光時間、及び蛍光体100重量部を水に浸漬し 500時間経過後に取り出して乾燥したときの重量を図 り百分率で表した回収率について測定し、その結果を後 の表3に示す。

【0294】(実施例7) Nd2 O3 を0.9モル、Y b2 O3 を0.1モル、CaCO3 を5モル、MoO3 を8モル採取して、これを充分に混合粉砕し、アルミナ 製るつぼに移して電気炉に入れ、約180℃/hrの昇 温速度で750℃に昇温し、750℃で2時間焼成し た。焼成終了後冷却し、乳鉢で粉砕して、蛍光体Nd 40 1.8 Ybo, 2Ca5 (MoO4) 8 を得た。

【0295】(実施例8) Nd2 O3 を0.9モル、Y b2 O3 を O. 1モル、CaCO3 を 21モル、MoO 3 を24モル採取して、これを充分に混合粉砕し、アル ミナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約180℃/hr の昇温速度で750℃に昇温し、750℃で2時間焼成 した。焼成終了後冷却し、乳鉢で粉砕して、蛍光体Nd 1.8Yb0.2 Ca21 (MoO4)24を得た。

【0296】(実施例9) Nd2 O3 を4.5モル、Y b2 O3 を0. 5モル、CaCO3 を9モル、MoO3

ナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約180℃/hrの 昇温速度で750℃に昇温し、750℃で2時間焼成し た。焼成終了後冷却し、乳鉢で粉砕して蛍光体Ndg Y bCag(MoO4)24を得た。

【0297】(実施例10) Nd2 O3 を4.5モル、 Yb2 O3 を0. 5モル、CaCO3 を9モル、WO3 を24モル採取して、これを充分に混合粉砕し、アルミ ナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約250℃/hrの 昇温速度で1000℃に昇温し、1000℃で2時間焼 成した。焼成終了後冷却し、乳鉢で粉砕して赤外発光蛍 10 光体NdgYbCag (WO4)24を得た。

【0298】(実施例11) Nd2 O3 を1モル、Ca CO3 を21モル、MoO3 を24モルを採取して、こ れを充分に混合粉砕し、アルミナ製るつぼに移して電気 炉に入れ、約180℃/hrの昇温速度で750℃に昇 温し、750℃で2時間焼成した。焼成終了後冷却し、 乳鉢で粉砕して蛍光体Nd2 Ca21 (MoO4)24を得

【0299】(実施例12) Nd2 O3 を0.9モル、 Yb₂O₃をO.1モル、CaCO₃を5モル、MoO 20 3 を8モル採取して、これに粉末フラックス原料として Na₂ MoO₄ · 2H₂ Oをモル比1:8で充分に混合 粉砕し、アルミナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約1 80℃/hrの昇温速度で750℃に昇温し、750℃ で2時間焼成した。焼成終了後冷却し、純水中で1時間 超音波洗浄をしてフラックス材料を除去し、120℃で 2時間乾燥させて蛍光体Nd1.8 Ybo.2 Cas (Mo O₄) 8 を得た。

【0300】この蛍光体の発光スペクトルを図23に、 の粒子構造の写真を図25にそれぞれ示す。

【0301】また蛍光体100重量部を水に浸漬し50。 0時間経過後に取り出して乾燥した蛍光体の発光強度、 応答速度及び粒子形状に変化はなかった。さらにこの蛍 光体を1NのNaOH及びCH3 COOHに24時間浸 漬した時の溶解度は0.9重量%であり、浸漬液から取 り出して乾燥した蛍光体の発光強度、応答速度及び粒子

形状に変化はなかった。

【0302】(実施例13) Nd3 O3 を0.9モル、 Yb3 O3 を0. 1モル、CaCO3 を5モル、MoO 3 を8モル採取して、これに粉末フラックス原料として Na₂ WO₄ · 2H₂ Oをモル比1:6で充分に混合粉 砕し、アルミナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約18 0℃/hrの昇温速度で750℃に昇温し、750℃で 2時間焼成した。焼成終了後冷却し、純水中で1時間超 音波洗浄をしてフラックス材料を除去し、120℃で2 時間乾燥させて蛍光体Nd1.8 Ybo.2 Ca5 (MoO 4)8 を得た。

【0303】(実施例14) Nd2 O3 を0.9モル、 Yb2 O3 を0.1モル、CaCO3 を5モル、MoO 3 を8モル採取して、これに粉末フラックス原料として K2 WO4 をモル比1:6で充分に混合粉砕し、アルミ ナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約180℃/hrの 昇温速度で750℃に昇温し、750℃で2時間焼成し た。焼成終了後冷却し、純水中で1時間超音波洗浄をし てフラックス材料を除去し、120℃で2時間乾燥させ て蛍光体Nd1.8 Yb0.2 Ca5 (MoO4)8 を得

【0304】(比較例9) Nd2 O3 を0.9モル、Y b2 O3 を0. 1モル、Na2 CO3 を5モル、MoO 3 を8モル採取して、これを充分に混合粉砕し、アルミ ナ製るつぼに移して電気炉に入れ、約160℃/hrの 昇温速度で650℃に昇温し、650℃で2時間焼成し た。焼成終「後冷却し、乳鉢で粉砕して蛍光体Ndo.s Ybo,1Na5 (MoO4), を得た。

【0305】(比較例10) Nd2 O3 を0.2モル、 パルス光励起に対する応答波形を図24に、この蛍光体 30 Yb2O3を0.2モル、Y2O3を0.6モル、Li H2 PO4 を12モル採取して、これを充分に混合粉砕 し、アルミナ製るつぼに移して電気炉に入れ、700℃ で2時間焼成した。焼成終了後冷却し、1NのHNO3 で酸洗し、さらに純水で水洗した後、乾燥させて蛍光体 Ndx YbyY1-x-y PO4 を得た。

> [0306] 【表3】

【表3】

	世光体の粒子の形態	平均粒邊	発光波長	残光時間	回収率
		(µm)	(nm)	(µ =)	(%)
支施例 7	粒状粉末の凝集体	3	980	370	98
实施贸 8	粒状粉末の凝集体	2	980	500	99
支施例9	粒状粉末の凝集体	,	980	240	97
実施例/0	粒状粉末の凝集体	4	980	340	97
実施例!」	粒状粉末の凝集体	3	890 t 1060	140	99
实施例/2	凝集のない観粒状	0.7	980	310	99
实施例/3	経集のない類粒状	0.8	980	360	99
実施例/4	凝集のない顆粒状	0.7	980	360	98
比較例9	凝集のない角形状	10	980	650	86
比较例10	凝集のない角形状	,	980	1500	98

【0307】この表3より明らかなように、従来の蛍光体では応答速度が遅く、短パルス光励起、高速スキャンなどの高速読み取りには適さなかったが、本発明の蛍光体は応答速度が速く、短パルス光励起、高速スキャンなどの高速読み取りが可能で、しかも耐久性が高く、特に実施例12~14のものは各種印刷に適した粒径1μm以下の超微粒子状の蛍光体が得られることが分かる。

【0308】また、実施例12と比較例9の蛍光体を純水に浸漬させたときの回収率の経時変化を図26に示す。これは蛍光体100重量部を水に浸漬し、一定時間経過後に取り出して乾燥したときの重量比を測定し百分率で表したものである。

【0309】この図から分かるように、比較例9では1 0重量%以上の蛍光体が溶出するのに対して、実施例1 2ではほとんど溶出しせず耐水性に優れている。なお、 本発明の他の実施例で得られた蛍光体も同様に耐水性に 優れていることが確認されている。

【0310】この実施例12で作製した蛍光体75重量 部を、ワックス15重量部、ポリエステル5重量部、ポ*50

*リウレタン5重量部の混合物である透明バインダーに分散させ、蛍光体を印刷するインクを作製した。そしてこのインクを、厚み50μm、幅1cmのテープ状のポリエチレンテレフタレートに乾燥厚みが5μmになるように塗布して、熱転写印刷用のインクリボンを作製した。【0311】このインクリボンを用いて10桁の数値を表すバーコードを印字し、これを0.8msec周期の波長810nmのパルス赤外光で励起させ、0.9m/secの走行速度で残光を識別するシステムにかけたところ、バーコードで印字された10桁の数値情報を確実

【0312】2. [蛍光体組成物の印刷方法ならびに潜像マーク形成部材]

に読み取ることができた。

前述した各蛍光体組成物の印刷方法としては、インクジェット記録方式が高速印刷に適している。このインクジェット記録方式としては、例えば

- ①. 静電誘引力を利用してインクを吐出させる電界制御 方式、
- 2. ピエゾ素子の波動圧力を利用してインクを叶出させ

るドロップ・オン・デマンド方式(圧力パルス方式)、 3. 高熱によって気泡を形成して、成長させることによ って生じる圧力を利用してインクを吐出させるバブルジ ェット方式などが適用可能である。

【0313】図27は、前記電界制御方式を説明するた めの原理説明図である。この電界制御方式は、印刷すべ きマークや文字などをドットマトリックスに画素分割 し、各画素がもつ位置情報に比例した電圧でインク粒子 を帯電させ、その後静電場で偏向して、被検出体に印刷 する方式である。

【0314】この電界制御方式の原理を図27とともに 説明する.インクボトル1に貯えられたインク2は供給 ポンプ3で加圧され、調圧弁4で一定圧力に調整され て、ノズル5から噴出される。

【0315】このノズル5内に設置されている電歪素子 6は、励振源7によって一定の周波数で振動している。 ノズル5より液柱となって噴出したインクは、前記電歪 **素子6の振動周期に同期して一定の大きさのインク粒子**

【0316】インクを粒子化する位置に設けられた帯電 20 であることが判明した。 電極8に、記録すべき情報信号に応じた電圧が印加さ れ、粒子化のタイミングに合わせてインク粒子1個毎の 帯電量が制御される。

【0317】このインク粒子は、所定の電圧が印加され ている偏向電極9、9間を通過するとき、帯電量に応じ た偏向を受けて、印刷されるべき部材に到達する。前記 偏向と、ノズル5と部材間の相対移動速度によって決め られた大きさの潜像(マーク)が部材の表面にドット状 に印刷されて潜像形成部材10となる。

受けずにガター11によって捕集されて回収ポンプ12 で前記インクボトル1に回収される。

【0319】前述の蛍光体組成物が印刷される部材とし ては例えば証券、伝票類、カード類、書籍類、各種部 品、各種製品など何でも適用可能である。

【0320】印刷層中における蛍光体粒子の含有率につ いて種々検討した結果、蛍光体粒子の含有率が1重量% 以下であると所望の発光強度が得られない。蛍光体粒子 の含有率が増すに従って発光強度は除々に大きくなる が、50重量%以上になると蛍光体粒子の凝集、重なり 合いが実質的に多くなり、発光強度はさほど大きくなら ず、むしろ蛍光体粒子の含有率が30重量%を超すと印 刷層の存在が目立つとともに、特に無機化合物からなる 比較的粒径の大きい蛍光体粒子を使用した場合には、イ ンクジェットプリントやスクリーン印刷などの印刷性が 低下する.

【0321】従って、印刷層中における蛍光体粒子の含 有率を1重量%を超えて30重量%未満に規制すること により、所望の発光強度を維持し、しかも印刷層の存在

62

することがなく、印刷性が良好である。特に前述のよう に平均粒子サイズが4μm以下、さらに好ましくは2μ m以下の蛍光体微粒子を使用するものにおいて好適な含 有率である。

【0322】また印刷層の厚さと使用する蛍光体粒子の 大きさとの関係について検討した結果、印刷層の厚さは 使用する蛍光体粒子の平均粒子サイズの35倍以内、好 ましくは25倍以内に規制する方が、印刷層の存在が手 触りなどによっても殆ど分からず(目立たず)、そのた 10 めに潜像形成部材の外観を損ねたりすることがない。従 って蛍光体粒子の平均粒子サイズが4μmの場合は印刷 層の厚さを140μm以下に、平均粒子サイズが2μm の場合は印刷層の厚さを70μm以下にすればよい。

【0323】蛍光体微粒子を分散、保持するためのバイ ンダの光透過率について検討した結果、励起光ならびに 蛍光に対する光透過率が80%以上、好ましくは90% 以上のものを使用すると、印刷層への励起光の進入なら びに印刷層内で発した蛍光の外部への放射が効率的に行 われ、そのため発光出力が大となり、潜像の検出が確実

【0324】次に本発明者らは、印刷層の表面状態につ いて検討した。蛍光体微粒子を含有した塗料を合成樹脂 フィルム上に塗布して印刷層を形成した場合と、同様の 組成の塗料を紙の上に塗布して印刷層を形成した場合と で発光出力の比較を行ったところ、紙の上に塗布した方 が出力が大であった。

【0325】前述の合成樹脂フィルム上に塗布して形成 した印刷層の表面状態を観察してみると非常に平滑であ るのに対して、紙の上に塗布した印刷層は表面に微細な 【0318】印刷に使用されなかったインクは、偏向を 30 凹凸がある。この微細な凹凸のために照射した励起光が 正反射せずに、蛍光体の活性化に関与して大きな発光出 力が得られるものと考えられる。特に蛍光体粒子の平均 サイズが紙を構成する繊維の径よりも小さい(例えば平 均サイズが O. 2 μm程度)場合、不規則無方向状に絡 みあった繊維の表面に蛍光体粒子が色々な角度で付着す るから、蛍光体の励起効率が高い。

> 【0326】後述するように印刷層を例えば郵便物や宅 配便などの配達物、あるいはプリペイドカードや通行力 ードなどのカード上に形成する場合、印刷層は外観上目 40 立たない方がよい。目立たない印刷層にするためには、 前述のように印刷層の厚さなどを制限する手段もある が、印刷層の可視光吸収率を制限する方法もある。

【0327】印刷層の主成分はバインダと蛍光体粒子で あり、これらの材質として可視光吸収率の小さいものを 使用して、結果的に印刷層の可視光吸収率を20%以 下、好ましくは10%以下に規制することにより、印刷 層はほとんど無色、透明に近くなり、そのために潜像形 成部材の外観を損ねないことが分かった。

【0328】また本発明の実施例に係る潜像形成部材 が目立たず、そのために潜像形成部材の外観を損ねたり 50 は、電子写真法によって複写しても印刷層の部分が転写

紙上に複写されないかあるいは殆ど目立たないから、印 刷層の形成によって転写紙表面が汚れたりする心配はない。

【0329】郵便物に蛍光体組成物からなる潜像を形成した具体例を図28に示す。

【0330】同図に示すように例えば封書、葉書、郵便小包などの郵便物13の表面には切手14が貼着され、郵便番号15が記入され、送先住所16ならびに宛名17が記載されているが、これらの他に例えば送先住所に関するバーコード情報が所定の位置にイングジェット記録方式によって印刷されて印刷層18が形成されている。なお、このバーコード情報は潜像であるため、郵便物13の外観を損ねる心配はない。

【0331】図29は郵便物13の他の例を示す図で、この例の場合は送先住所が予め決まっており、送先住所に関するバーコード情報が前記蛍光体組成物によって印刷されたラベル19を発送人が保持している。そして郵便物13を発送する際に、前記ラベル19を郵便物13の所定位置に貼着して、郵便局に提出する。なお、ラベル19の貼着位置は郵便物13毎に異なっては情報の読み取りに支障をきたすため、郵便物13の表面にラベル貼着位置が印刷されており、その位置にラベル19を貼着するようになっている。

【0332】この例では郵便物について説明したが、宅配便、社内のメール便など他の配達物にも適用可能である。

【0333】またこの例では送先住所に関する情報を前 記蛍光体組成物によって印刷しているが、他に送先名、 送り元住所、送り元名、あるいは他の必要な情報なども 印刷可能である。

【0334】図30は、前記パーコード情報の付与と、その情報の読み取りの工程を説明するためのフローチャートである。

【0335】郵便局に集められる郵便物13はまず方向 揃え装置20に投入されて、その方向が揃えられる。そ して郵便物13には前記ラベル19が貼着されているも のとそうでないものとが混在しているから、選別装置2 1によりラベル19が貼着されているものとそうでない ものとに選別される。この郵便物13の選別は、ラベル 19が貼着されている個所に所定の波長領域の赤外線を 級射して、蛍光を発すればラベル19が貼着されている 郵便物13であると判断され、蛍光を受光しなければラ ベル19が貼着されていない郵便物13であると判断されて、両者の選別が行われる。

【0336】ラベル19が貼着されていない郵便物13はOCR22に送られて郵便物13上に記載されている郵便番号15ならびに送先住所16が光学的に読み取られ、この読み取られた情報に基づいて、インクジェットプリンタ(IJP)23によって送先住所に関するバーコード情報が郵便物13の所定位置に印刷される。

64

【0337】このようにして印刷された郵便物13はバーコード区分け装置24に送られ、バーコード情報を光学的に読み取って、そのバーコード情報に基づいて郵便物13を自動的に区分けする。

【0338】ラベル19を貼着した郵便物13はバーコード情報を印刷する必要がないから、直接にバーコード区分け装置24に送られて、郵便物13の区分けが行われる。

7か記載されているが、これらの他に例えば送先住所に 【0339】前記バーコード区分け装置24は、バーコ 関するバーコード情報が所定の位置にイングジェット記 10 一ド情報を光学的に読み取る読取装置と、読み取られた 録方式によって印刷されて印刷層18が形成されてい バーコード情報に基づいて郵便物13を区分けする区分 る。なお、このバーコード情報は潜像であるため、郵便 け装置とから主に構成されている。

【0340】(光学読取装置の実施例1)図31は、その読取装置25の概略構成を示す図である。読取装置25はリーダ光学系と読取り回路とから主に構成されている。

【0341】そしてリーダ光学系は半導体レーザ駆動回路26と、半導体レーザ27と、レンズ28と、全反射のミラー29と、平凸レンズ30、31と、スリット32と、フィルタ33と、フォトダイオード34とから構成されている。

【0342】前記半導体レーザ27から照射された励起 光60はレンズ28で直径約1mmに集束され、図31 ならびに図32に示すようにミラー29の中央に開設さ れた直径が約2mmの透孔35を通り、レンズ30を介 して潜像形成部材10である郵便物13の平面に対して 垂直に照射される。

【0343】励起光60を集束しないでミラー29側に出射すると励起光60の一部が前記透孔35の外周部によってカットされ、そのために郵便物13側に到達する励起光60の光量(励起エネルギー)が実質的に減少し、結果的には発光出力が小さくなるから、励起光60を集束径を前記透孔35の直径以下に規制する必要がある。本実施例では部品取付位置の誤差などを考慮して、透孔35の直径が2mmに対して励起光60の集束径を1mmにしている。

【0344】この郵便物13は例えば4m/secの高速で矢印方向に搬送され、その間にバー状の印刷層18を照射し、蛍光体を励起して、蛍光を第1平凸レンズ30で受光する。受光された光はミラー29で反射されて、第2平凸レンズ31で集束され、スリット部材32ならびにフィルタ33を透過して、フォトダイオード34で受光される。

【0345】前記読取り回路は、増幅回路とフィルタ回路を備えた検出回路36と、二値化処理回路37と、デコード回路38と、シリアルインタフェイス39と、データ処理用のパーソナルコンピュータ40とから構成されている。

【0346】前記ミラー29の代わりにハーフミラーを 50 使用することもできるが、ハーフミラーであれば励起光 のうち半分しか郵便物13側に照射することができず、また蛍光のうち半分しかフォトダイオード34側に反射することができず、そのために出力が低減する。本発明では反射光量の増大を図り、郵便物13のバーコード情報を高速でかつ正確に読み取るために、微細な透孔35を形成した反射率が50%を超える高反射率のミラー29を使用している。本実施例でのミラー29は、ガラスの表面にアルミニウムなどを蒸着して形成した前鏡面ミラーを使用している。

【0347】また、郵便物13には色々な厚さのものが 10 あり、また搬送系の光軸方向に対する揺れなどがある。それに対応するためミラー29を通過した光は郵便物13の平面に対してほぼ垂直に入射している。このようにすれば郵便物13の厚さが変動したり、搬送系の光軸方向に対する揺れなどがあっても、それらにほとんど影響されずにバーコード情報を読み取ることができる。

【0348】図33は、前記スリット部材32の働きと問題点を説明するための図である。この例では第1平凸レンズ30の前方にスリット部材32が配置されており、郵便物13(潜像形成部材10)の印刷層18から発した蛍光61はスリット部材32のスリット32aを通って第1平凸レンズ30側に導かれる。

【0319】同図において実線で示しているように印刷層18がスリット32aと対向したときに発した蛍光61はスリット部材32を通して受光するが、郵便物13(潜像形成部材10)の搬送によってスリット32aの下を通過した印刷層18から発した蛍光61(点線で表示)はカットするように、スリット部材32が設けられている。このようにスリット32aと対向した印刷層18からの蛍光61のみを選択するために、スリット部材3032は郵便物13(潜像形成部材10)の搬送手段62に可及的に近ずけて配置されている。

【0350】そのため厚い郵便物13が搬送されてくると、郵便物13の先端部がスリット部材32に当たって停止したり、スリット部材32が損傷を受けるなどの弊害を生じていた。

【0351】そのため本発明は図31に示すように、スリット部材32を郵便物13の搬送路上から外して、第2平凸レンズ31と受光素子34の間に配置した。このようにすることにより、スリット部材32の機能を備え 40ながら、搬送手段62と第1平凸レンズ30との間が大きくとれ、厚い郵便物13も通過が可能となる。

【0352】図34、35は、半導体レーザから出力されるレーザ光の放射パターンと、バーコードパターンの関係を説明するための図である。半導体チップ41は図34に示すように、A1電極42、p-電極43、p-GaAs基板44、n-GaAsからなる電流閉じ込め層45、p-Ga1-x A1x Asからなる活性層47、n-Ga1-x A1x Asからなるクラッド層48 n-Ga

. 66 Asからなるキャップ層49、n-電極50の積層体か

Asからなるイヤッノ眉49、II = 電巡りしいる ら構成されている。

【0353】そしてこの半導体チップ41から出力されるレーザ光の放射パターン51は楕円形をしている。従来はこの楕円形の放射パターン51を円形に成形してバーコードの検出に使用していたが、本発明では図35に示すように潜像形成部材に印刷されたバーコード状の印刷層18の長手方向が前記放射パターン51の長手方向に向くように、印刷層18に対して照射される。

【0354】このようにすれば、円形の放射パターンを使用するものよりも印刷層18に対する照射面積が増大し、その結果大きな出力が得られ、高速読み取りに適している。

【0355】郵便物13は例えばガイド付きのベルトコンベアなどからなる搬送手段62で搬送されながら光学 読取装置の下を通過する訳であるが、ガイドがあっても 郵便物13は最高で10度程度傾斜する場合がある。図36は郵便物13が傾斜したとき(傾斜角度:約7度)の極細の印刷層18と放射パターン51との対向状態を 3に上で、このとき放射パターン51の短軸64が余り長いと隣の印刷層18も読み取る場合がある。本 発明者らの諸種の検討結果、放射パターン51の長軸63に対する短軸64の比(長軸/短軸)が15を越えると前述のように相対的に傾斜した際に隣の印刷層18の情報までも読み取ることがあるから、放射パターン51の長軸63に対する短軸64の比(長軸/短軸)は15以下に規制するとよいことを解明した。

【0356】(光学読取装置の実施例2)図37ならびに図38は、ミラーならびにそれを用いた光学読取装置の実施例2を示す図である。

【0357】この例の場合は図37に示すように、反射率が50%を越す高反射率ミラー29の周辺部にスリット53が形成されている。そして図38に示すようにこのスリット53を通して半導体レーザ27からの励起光60が郵便物13の印刷層18に照射される訳であるが、前記スリット53を通して郵便物13上に投影される放射パターンの長手方向が印刷層18のバーコードの長手方向を向いている。そうすることにより、前述の楕円形の放射パターンと同様にバーコードの長手方向の殆どの部分を照射でき、大きな出力が得られる。

【0358】(光学読取装置の実施例3)図39ならびに図40は、赤外発光蛍光体の他の使用例を示す図である。図39に示すように、有価証券55の所定位置には3つの印刷層18a、18b、18cが設けられ、各印刷層18a~18cは互いに異なる発光スペクトルを有する蛍光体をそれぞれ含有している。

GaAs基板44、n-GaAsからなる電流閉じ込め【0359】そして各印刷層18a~18cに対して、層45、p-Ga1-x Alx Asからなるろラッド層4それぞれ所定の励起光を照射する半導体レーザ27a,6、p-Ga1-x Alx Asからなる活性層47、n-Gai-x Alx Asからなるクラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層48、n-Gai-x Alx Asからなるグラッド層480、n-Gai-x Alx Asからなんのグラッド層480、n-Gai-x Alx Ashonox Ashon

34cとが対になって配置されている。

【0360】前述の異なる発光スペクトルを有する蛍光体としては、例えば図13に示す発光スペクトルを有するNdo.1 Ybo.1 Yo.8 PO4 、図14に示す発光スペクトルを有するYbo.1 Yo.9 PO4 ならびに図17に示す発光スペクトルを有するEro.2 Y2.8 Fe1.5 Al3.5 O12などが適宜選択して用いられる。

【0361】従って前記印刷層18a~18cに前述の 蛍光体を使用した場合、それぞれの蛍光を前記フォトダ イオード34a,34b,34cで受光することによっ10 て、その有価証券55が真正のものであると判断され る。もし、フォトダイオード34a,34b,34cの うち1つでも受光しないフォトダイオード34があれば、その有価証券55が真正のものでないと判断される。

【0362】図39の例では発光スペクトルの異なる蛍光体を個別に使用した場合を示したが、図40に示すように発光スペクトルの異なる蛍光体を混合して印刷層18を形成することも可能である。

【0363】この場合、その印刷層18に対して半導体 20レーザ27a,27b,27cから励起光が照射され、印刷層18から発せられる蛍光をフォトダイオード34a,34b,34cの受光面には、受光しょうとする光成分を透過して他の波長の光は遮断する光学フィルタが取り付けられている。

【0364】(光学読取装置の実施例4)図3の(c)に立ち下がり時間taの長い蛍光体の発光強度特性を示したが、このような特性を有する蛍光体は残光を利用し 30た情報の検出に好適である。

【0365】図41は、残光を利用した情報検出時の発光素子の発光タイミングならびに受光素子の出力の状態を示すタイミングチャートである。同図(a)に示すように発光素子は、点灯時間T1および消灯時間T2がほぼ等しい時間間隔でオン、オフ動作し、印刷層に対して間欠的に励起光を照射する。図中のS1は発光素子の点灯信号を示している。

【0366】発光索子からの光の照射で印刷層中の蛍光体が励起され、同図(b)に示すように発光索子からの40照射が終了するまでは出力が増大する。そして発光索子からの照射が停止しても、印刷層から放出される残光を受光素子が受光する。この残光は時間とともに減少するため、予め基準値Vsを設定しておき、この基準値Vsと比較することにより、発光素子からの照射が停止した後に矩形信号S3が得られる。

【0367】従って、微小時間毎に発光素子の点灯、消灯を繰り返すことにより、バーコードパターンのコード情報を光学的に読み取ることができる。

【0368】このように蛍光体の残光を利用する検出方 50 するモニタ用フォトダイオード81とから構成されてい

68

法は、情報を読み取る際には発光素子は消灯しているから反射光がなく、そのために高価な光学フィルタを使用しなくても蛍光を検出することができ、小型でかつ低価格の光学読取装置を提供することができる。

【0369】図42、43はこの残光検知に好適な光学 読取装置を説明するための図である。図42に示すよう に光学読取装置は、照射パルス周波数選択スイッチ7 0、パルス発振回路71、トランジスタ(Tr)72、 レーザ駆動電流制限用抵抗(R)73、オートマチック パワーコントロール(APC)機能を有する駆動回路7 4、半導体レーザダイオード75、集光レンズ76、受 光回路77、レーザ出力調整用ボリューム(VR)7 8、ホールド回路79などを備えている。

【0370】次にこの光学説取装置の動作について説明する。まず、照射バルス周波数選択スイッチ70によって適当な照射バルス周波数を選択し、それに相当するバルスをバルス発振回路71で作り、クロック(CLK)信号として出力する。

【0371】このCLK信号でトランジスタ(Tr)72をオン/オフし、APC駆動回路74から出力されるレーザ駆動電流Ioutの半導体レーザダイオード75への供給を制御する。レーザ駆動電流Ioutは、レーザ駆動電流制限用抵抗(R)73にてトランジスタ(Tr)72や半導体レーザダイオード75を破壊しないように制限する。

【0372】半導体レーザダイオード75からパルス状に出力された励起光60は、集光レンズ76を通って、潜像形成部材10上の印刷層18を照射し、半導体レーザダイオード75のオフ時に印刷層18から発せられた蛍光61(残光)は、受光回路77にて検出される。

【0373】所定の間隔で一定のバルス状励起光を半導体レーザダイオード75から得るため、APC駆動回路74で半導体レーザダイオード75のモニタ光を検出して、レーザ駆動電流Ioutにフィードバック制御をかけている。

【0374】このモニタ光の検出ばモニタ電流 I i n として半導体レーザダイオード75から得られ、半導体レーザダイオード75のオン時のモニタ電流 I i n をホールド回路79にてピーク検知あるいはサンプリングして、半導体レーザダイオード75のオフ時にその状態をホールドすることで、次の半導体レーザダイオード75のオン時に蛍光体の励起がスムーズに行えるように、半導体レーザダイオード75の励起光を制御する。なお、蛍光体の励起に必要な半導体レーザダイオード75の出力は、前記レーザ出力調整用ボリューム(VR)78で予め調整しておく。

【0375】図43は前記半導体レーザダイオード75の構成を示す図で、励起光を出力する半導体レーザ80と、その半導体レーザ80から出力された励起光を受光するチニタ甲フェトダイオード81とから機成されてい

ð.

【0376】励起光の光源としてLEDを使用して、ト ランジスタによるスイッチングでパルス状の励起光を出 力すると、集光レンズを用いて励起光を絞っても検出時 に十分な発光強度を得るのが難しく、情報読み取りのた めの光路長が制限される。

【0377】これに対して図42、43の読取装置で は、励起用光源として集光性、指向性の優れた半導体レ ーザダイオードを使用しているため、読取装置の光路長 を長くしても検出時に十分な発光強度が得られる。

【0378】またAPC機能を有する半導体レーザダイ オードの駆動回路を用いることにより、励起光の温度変 化による影響を軽減もしくは無くすことができ、読み取 りの信頼性が向上する。

【0379】さらに半導体レーザダイオードのオン時の モニタ電流をホールドして、その値に基づいて半導体レ ーザダイオードの駆動回路をフィードバック制御するこ とにより、バルス周波数変動やデューティ比に関係なく APC機能が発揮され、蛍光体の励起がスムーズに行 え、読み取りの信頼性が向上する。

【0380】(光学読取装置の実施例5)次に実施例5 に係る光学読取装置について説明する。例えばキャッシ ュカードなどのカード80は、図44に示す如く、基材 81として例えば白色のポリエステルフィルムを使用し て、その基材81の上面側に、予め反射率を調整した任 意の意匠の下地層82を印刷形成し、下面側に磁性塗料 を塗布することにより主情報を書き換え可能に記録する 磁性層83を形成している。更に、上面側の下地層82 上に蛍光体を含有したマーク84を印刷形成し、これに よってセキュリティ用の副情報を固定的に記録する。

【0381】前記マーク84は、例えば赤外線領域の照 射光85の照射に対応して、それの中心波長とは異なる 波長の蛍光86を発生する蛍光体で構成される不可視状 態の、すなわち潜像であって、カード80の長手方向と 直交する細いバーコード状をしている。このマーク14 の形成で、カード発行店コードあるいは暗証番号などの 所定のセキュリティ用の副情報がカード80上に記録さ れることになる。

【0382】マーク84として形成されるパーコード は、図45(d)に例示する従来のバーコードにおける 40 地模様部87と複数本のバー88により構成されるデー タ部89bとを、同図(a)のように反転させたもので あって、少なくとも各バー88間に設けた間隙90およ びデータ部89の走査方向前後を挟む導入部91、91 aを蛍光体層により形成している。

【0383】かかる構成をとることにより、データ部8 9をどちらの方向から走査しても、その前後において必 ず、データ部89を構成する各バー88および間隙90 の幅より十分長く持続する導入部91を通過させ、デー 夕部89の位置を容易に検知できるようにする。また、 50 に、光ガイド103の全体をマーク84の移行方向と直

70

データ部89の全域におけるコントラストの均一化を図 り、走査開始位置における最初のバー88aの太さを誤 って検出するのを防止する。

【0384】なおマーク84を構成する蛍光体として は、前記各種蛍光体ならびにネオジウム(Nd)、イッ テルビウム (Yb)、ユーロビウム (Eu)、ツリウム (Tm)、プラセオジウム(Pr)、ジスプロシウム (Dy) などの希土類元素単体、もしくはそれらの混合 物を光学活性元素とし、その光学活性元素が燐酸塩、モ 10 リブデン酸塩、タングステン酸塩等の酸化物が母体に含 まれる化合物が用いられる。しかし、任意波長の光を照 射することにより、残光性を有する蛍光86を発生する ものであれば、その材料を適宜変更して実施できる。

【0385】本実施例では、Li (Ndo.9 Ybo.1) P4 O12のような蛍光体を含む蛍光塗料を印刷してマー ク84を形成し、波長が800mm付近の近赤外領域の 励起光を照射した時、1000nm付近の波長でビーク 値を持つ赤外領域の蛍光86を発生し、励起光の照射を 停止した際に光強度が10%に減衰するまでの時間が4 20 00~600µsec程度の残光特性を有している。

【0386】本実施例に係る光学読取置は図46に示す 如く、前記カード80の走行部92と、その走行部92 によって搬送されるカード80に対する光照射部93 と、光が照射された位置から放出される光94を取り込 んで電気信号に変換する光電変換部95と、変換された 電気信号中からマーク84の形成位置に対応したマーク 信号S4を検出するマーク検出部96と、検出したマー ク信号S4からカード80上のデータ内容を判定するデ ータ処理部97とを備えている。

【0387】前記走行部92は、カード80の挿入時期 に対応してモータ駆動回路98で回転駆動されるローラ 99によってカード80の両側縁を支持しながら、例え ば毎秒200~400mm程度の一定速度で搬送させる ことにより、カード80の上面側に形成されたバーコー ド状のマーク84が、光照射部93と光電変換部95の 下方位置を通過する。このモータ駆動回路98の動作時 期に関するデータはデータ処理部97に対して送られ、 マーク内容を判定するためのデータ処理の必要時期を知 らせる。

【0388】光照射部93は、マーク84の検出時期に 対応して所定の直流電圧を出力する発光源駆動電源10 0と、その発光源駆動電源100の通電により所定の光 85を発生する発光源101から構成される。

【0389】発光源101は、発光中心波長が800n m付近の近赤外線を発生する発光ダイオードなどの発光 素子102の光放出部分に、図34に示す如くグラスフ ァイバー製の光ガイド103が取り付けられている。こ の光ガイド103の先端を、カード80の表面に対して 2mmあるいはそれ以下の距離にまで接近させるととも

る.

交する面上で且つ水平方向から45~60°の傾斜角。 $(\theta 1)$ を設けて配置している。

【0390】このカード80上における光照射位置から 放出される光94を電気信号に変換する光電変換部95 は、入射した光を電流に変換する検出器104と、電流 を電圧に変換したのち増幅する交流増幅回路105から 構成される。

【0391】検出器104は図44に示すように、赤外 域に受光感度を有するフォトセルやフォトダイオードの される蛍光86の波長の光を選択的に通す光学フィルタ 107を介して、発光源101側と略同様な光ガイド1 08が固定されている。

【0392】検出器104側の光ガイド108の先端を 前記光ガイド103の先端に接近させ、マーク84の移 行方向と直交する面上で且つ例えば105~115・程 度の傾斜角 (θ 2) を設けることにより、マーク84の 表面に対する照射光85の照射位置から発せられる反射 光109と蛍光86を含む光94を入射光として内部に 取り込む。この取り込まれた光94は、受光素子106 で入射光の強度に比例した図47(b)に例示するよう な電圧に変換するとともに、交流増福回路105で所定 の電圧値に増幅した後、その信号S5をマーク検出部9 6に入力し、マーク位置に対応した信号を取り出す。

【0393】マーク検出部96は、マーク形成位置に対 応した図47(c)のようなマーク信号S4を出力する 比較回路110と、その比較回路110における比較値 Vcを設定する比較値設定回路111と、マーク84中 のデータ部89を判定するデータ部判定回路112から 構成される。

【0394】比較値設定回路111は、光電変換部95 から送られる電気信号S5におけるマーク84の導入部 91に対応する部分を検出し、その導入部91における レベルに比例させて比較値Vcを決定して比較回路11 0に入力する。それと同時にデータ部判定回路112に 向けて所定の信号S6を送り、データ部89の検出を開 始したことを知らせる。

【0395】データ部判定回路112は、比較回路11 0に対して比較値Vcと入力信号S5の比較時期を知ら せるもので、前記比較値設定回路40から送られるスタ 40 ート信号S6によりデータ部89の走査開始を検出する 一方、比較回路110から出力される信号S4によりデ ータ部89の終了を検知し、信号S7を比較回路110 に入力する。

【0396】比較回路110は、光電変換部95から送 られる信号S5のレベルが設定値Vcを下回る時期に対 応して、図47(c)のように矩形波状の信号S4を出 力するもので、この出力信号S4はデータ処理部97に 順次送られ、信号S4のパルス幅とパルス間隔を測定す

【0397】次にマーク検出部96の動作を図48のフ ローチャートとともに説明する。まずステップ120で 動作をスタートさせると、ステップ121で初期設定を 行ない、ステップ122から始まる比較値設定工程に入

【0398】比較値設定工程では、光電変換部95から 送られる入力信号S5を微分するなどして、信号レベル が急激に立ち上がる時期をステップ122で常時監視す ような受光素子106の受光面に、マーク84から発生 10 る。ここで図47における時刻t1に立ち上がりが検知 されると、ステップ123でタイマーを始動して計時を 開始し、ステップ124で入力信号の立ち下がりが検出 されるのを待つ。

> 【0399】信号レベルの立ち下がりが認められると、 更にステップ125でタイマーの経過時間を調べる。そ の時、経過時間が予め設定した時間を下回っていること が判定されると、ノイズなどの不要な信号入力と判断し てステップ122の前段に戻る。しかし、時刻t2に検 出された信号レベルの立ち下がり時に、ステップ125 で設定時間の経過が認められると、例えばサち上がりか ら立ち下がりまでの信号レベルの平均値Vmを予め設定 した割合で分圧した電圧値をステップ126で比較値V cとして決定し、比較回路110に入力する。それと同 時に、ステップ127でデータ部判定回路112を介し て比較回路110に信号S7を送り、比較動作開始を指 示する。

【0400】比較回路110では、ステップ128の比 較処理工程において、入力信号S5のレベルが設定値V cを下回る期間に対応して「H」レベルの信号を、また 上回る期間に対応して「L」レベルの信号を各々出力す ることにより、本来のデータである蛍光体層が形成され ていない箇所に対応した矩形波状のマーク信号S4が出 力される。

【0401】このマーク信号S4は、同時にステップ1 29において「L」レベルの持続時間が検知され、かか る時間が予め設定した時間を超えることが判定される と、マーク84のデータ部89を過ぎてもう一方の導入 部91aに入ったことを比較回路110に知らせ、比較 処理工程を終了させる。

【0402】なお、前述した図45(a)のように従来 のコードマークの全体を反転させるのに代えて、図45 (b) のような反転したデータ部89あるいは図45 (c)のような反転しないデータ部89aの前後を導入 部91,91 aで挟んでもよい。またマーク84の走査 方向が一定であるなら、導入部91は走査の開始位置に 対応させて1か所のみ設けることで足りる。また導入部 91の形状も矩形状に限らず、データ部89との区別が 可能な形状であれば、任意に変更可能である。

【0403】またマーク検出部96は、光電変換部95 ることにより、マーク84のデータ部89内容を解析す 50 から送られる信号S5を上記の如く順次にデータ処理し

ていくのに代えて、一連の入力波形の変化をサンプリン グしながら一旦記憶し、そのデータを上記の手順あるい は類似の手順を利用して、マーク84の形成位置を検出 することも可能である。

【0404】更に、前述のように照射光85を連続的に 照射して蛍光86を検出する場合に限らず、照射光85 を断続させることにより、蛍光86の残光を検出してマ ーク84の形成位置を判定する場合にも利用でき、蛍光 86の検出方法は限定されない。

【0405】更にまた、光学読取装置側を固定してマー 10 ク84を移行させるのに代えて、例えば光照射部93と 光電変換部95を一体にした携帯型のプローブ形状と し、マーク84側を固定して光学読取装置側を手動ある いは自動的に移行させるようにしてもよい。また、照射 光85を所定の角度をもって走査させ、その走査位置か ら放出される光を検出器104で検出するようにしても よい。これらのことは、他の光学読取装置においても同 様である。

【0406】(光学読取装置の実施例6)次に光学読取 装置の実施例6を説明する。この実施例で使用されるカ 20 ード80ならびにマーク84の構成などは、前記実施例 5と同様であるから、それらの説明は省略する。

【0407】この実施例に係る光学読取装置は、図49 にその概略的な構成を示す如く、マーク16に対してそ の強さが略一定の光85を所定周期をもって断続的に照 射する光照射手段151と、光85の照射位置から放出 される入射光94を取り込んで電気信号に変換する光電 変換手段153と、前記光照射手段151における照射 光85の照射タイミングと同期させ、照射開始直前に対 射停止直後の検出値157とを個別に検知可能な波形検 出手段154と、前記最大値と最低値の差を分圧した比 較値158と前記検出値157とを比べて検出値157 が比較値158を超えるとマーク84の形成位置と判定 するマーク判定手段155とを備えている。

【0408】さらに前記光電変換手段153の入力側 に、入射光94から蛍光86と同一波長の光成分を選択 的に取り込む光学的沪波手段152を設け、前記波形検 出手段154を、所定のタイミングをもって入力波形の 値をサンプリングしてその値を次のサンプリング時まで 40 維持し、その波形検出手段154から出力される前記最 高値が有意な値か否かを判定する信号入力判定手段15 6を備えている。その信号入力判定手段156が最高値 を有為な値と判定した期間においてのみ、マーク判定手 段155が比較動作を行なうように構成されている。

【0409】より具体的に説明するとこの光学読取装置 は、図50にその全体の構成を示す如く、走行部92 と、光照射部93と、光電変換部94と、マーク検出部 95と、データ処理部36と、各種の制御信号を発生す る信号発生部130を備えている。

74

【0410】信号発生部130は、少なくとも光照射部 93で使用する駆動信号S8と、マーク検出部96で使 用する3種類のタイミング信号S9、S10、S11を 作成するもので、クロック信号S12の発生回路131 と、そのクロック信号S12から各種の制御信号を作成 する制御信号発生回路132から構成される。

【0411】クロック信号発生回路131は図52

(a)の如く、例えば100µsec程度の一定時間間 隔をもってパルス状のクロック信号S12を連続して発 生する。制御信号発生回路132では、5個のクロック 信号S12が入力される毎にその信号レベルを切り換え ることにより、図52(b)に示すような、約500^μ secの時間間隔をもってそのレベルが変わる矩形波状 の駆動信号S8が形成される。また制御信号発生回路1 32では、駆動信号S8の立ち上がり時から、例えば 4、6および9番目のクロック信号S12が入力される のと連動してパルス信号を出力させることにより、図5 2(c)~(e)のような駆動信号S8と同期した3種 類のタイミング信号S9~S11が形成される。

【0412】マーク検出部96は、図52(f)に示す 光電変換部95からの信号S13の変化を測定するサン プルホールド回路133と、第1ないし第3比較回路1 34, 135, 136と、第1および第2表示回路13 7,138とから構成される。

【0413】サンプルホールド回路133は図50に例 示する如く、OPアンプを使用した電圧バッファ回路1 39の入力側に、入力電圧値を保持するコンデンサ14 0と、前記信号発生部130から送られるタイミング信 号S9~S11の入力でオンするアナログスイッチ14 応する最低値と、照射停止直前に対応する最大値と、照 30 1を備えたものを1組のサンプリング回路142とし、 それを3組分備えている。

> 【0414】このサンプルホールド回路133は、前記 光電変換部95から送られる図52(f)で例示するよ うな入射光94の強度に対応した一連の電圧変化信号S 13を、複数の時点で個別的且つ周期的にサンプリング するとともに、その各検出値を次のサンプリング時まで 保持する。

【0415】本実施例では図52(c)に示すタイミン グ信号S9を第1サンプリング回路142a (図51参 照)に印加し、光85の照射を停止する直前の電圧値に よって、図52(g)の太線で示す入射光94の最大値 Vmを検出する。また、図52(d)で示すタイミング 信号S10を第2サンプリング回路142bに印加し、 光照射を停止した直後の電圧値によって、図52(g) の破線で示す残光の強度を電圧値Vdとして検出する。 【0416】さらに図52(e)で示すタイミング信号 S11を第3サンプリング回路142cに印加し、光8 5の照射を再開する直前の電圧値V1によって、図52 (8)の細線で示す入射光94の最小値を個別に検出す 50 る。このようにして、入射光94の波形の変化を電圧値 の変化として求め、全体に占める残光強度の割合が判る ようにしている。

【0417】前記各検出値の値を判定する第1比較回路 134にはOPアンプが使用され、そのマイナス側入力 端に前記第2サンプリング回路142bから取り出され た残光の電圧値Vdをそのまま検出値として入力する。 一方、第1および第3サンプリング回路142a, 14 2 cから取り出した電圧値の差を可変抵抗器 1 4 3 で分 圧し、その電圧値Vcを図52(g)において一点鎖線 により示す比較値として入力することにより、検出値V dが比較値Vcを超えると所定の信号S14が第3比較 回路136に出力される。

【0418】ここで第2比較回路134は、第1サンプ リング回路142aから出力される最高値Vmを所定の 設定値と比較し、最高値Vmが設定値を下回る期間は所 定の信号S15を出力しているが、最高値Vmが設定値 を超えると信号S15の出力を停止するものであって、 その出力端を順方向に繋いだダイオード144を介して 第1比較回路134の出力側と並列接続し、第3比較回 路136に対して信号入力するようにしている。

【0419】第3比較回路136は、第1比較回路13 4および第2比較回路135からの出力をOPアンプの マイナス側入力端に印加して設定値と比較し、出力側に 備えたFETによるスイッチング素子145をオンオフ 規制する。第1および第2比較回路134,135から の出力電圧がともに設定値を下回る期間は、マーク84 の検出に対応する「1」信号をデータ処理部97に出力 しているが、少なくともどちらか一方の比較回路13 4,135から「H」レベルの信号出力があると、デー タ処理部97に送られる信号S16がマーク84の不検 30 出を示す「〇」になる。

【0420】従って、入射光94の強度が低いために第 1比較回路134からの出力信号S14が不定となる期 間においては、第2比較回路135から「H」レベルの 信号S15が第3比較回路136のマイナス側入力端に 印加される結果、第3比較回路136の出力を強制的に 「0」状態にしてマーク84が検出されていないことを データ処理部97に知らせる。

【0421】逆に、入射光94の強度が一定値以上あっ てマーク検出が正常に行われる状態では、第2比較回路 40 135からの出力が「L」レベルに下がることにより、 第1比較回路134からの出力レベルの変化、すなわ。 ち、蛍光成分の検知に対応して第3比較回路136は作 動し、図52(h)に示すようにマーク検出の有無が判 定される。

【0422】第3比較回路136による判定可能時期に ついては、第2比較回路135の出力側に備えた第1表 示回路137のLED146を発光させて表示する。更 に、マーク84の検出時期については、第3比較回路1 36の出力側に備えた第2表示回路138のLED14 50 電気信号中からマーク84の形成位置に対応したマーク

7を発光させる。

【0423】サンプルホールド回路133の入力側に備 えたコンデンサ140と抵抗148および、第3比較回 路136の入力側に備えたコンデンサ149と抵抗15 0は、ともに積分回路が構成されており、パルス性のノ イズの入力によって入力レベルが瞬間的に上昇して誤動 作するのを防止している。

【0424】また本実施例における駆動信号S8の周期 は約1msecで、マーク84を構成する蛍光体の残光 時間の約2倍に設定しているが、周期および残光時間共 にその値を適宜変更できる。

【0425】またサンプル信号S9~S11の送出時間 タイミングも、蛍光86の発光特性に対応させて、照射 光85の点滅タイミングのより直近に設定することで、 蛍光86と反射光109の分離がより正確にできる。そ の場合、残光を検出することなく、光の照射開始直後と 照射停止直前における電圧値から、蛍光86の値を検出 することが可能となる。

【0426】更に、各検出値の比較動作も、前述のよう にOPアンプを用いたアナログ式のものに代えて、マイ クロプロセッサを使用したデジタル式のものでもよい。 その場合、入力波形の特徴部分における電圧値を選択的 にサンプリングするのに代えあるいは加えて、波形の全 体形状を検出して、その変化をデジタル処理して求める こともできる。

【0427】(光学読取装置の実施例6)次に光学読取 装置の実施例6について説明する。この実施例の場合も カード80ならびにマーク84の構成などは、前記実施 例5と同様であるからそれらの説明は省略する。

【0428】この実施例に係る光学読取装置は、図53 にその概略的な構成を示す如く、略一定の時間間隔で周 期的に断続しながら光85を放出する光照射手段160 と、光85の照射位置から放出される入射光94を入力 して電気信号に変換する光電変換手段162と、前記入 射光94のうちから蛍光86を選択的に取り込む光学的 沪波手段161と、前記光照射手段160の光85の照 射期間と90度位相がずれたタイミングで同期をとりな がら、前記光電変換手段162からの出力信号の半分を 反転増幅する波形整形手段163と、その波形整形手段 163の出力信号から直流成分を選択的に取り出す低域 通過型沪波手段164、その沪波手段164から出力さ れる検出電圧を比較電圧と比較して、検出電圧が比較電 圧を超えると所定のマーク信号を出力する比較手段16 5を備えている。

【0429】この光学読取装置を具体的に説明すると図 54に示す如く、カード80の走行部166と、カード 80上のマーク84に対する光照射部167と、光85 が照射されたマーク84上の位置から放出される光94 を電気信号に変換する光電変換部168と、変換された 信号S28を出力するマーク検出部169と、検出した マーク信号S28からカード80上のデータ内容を判定 するデータ処理部170とから構成される。

【0430】前記カード走行部166は、カード80の 挿入時期に対応してモータ駆動回路171で回転駆動さ れるローラ172によってカード80の両側縁を支持し ながら、例えば毎秒200~400mm程度の一定速度 で水平移行させることにより、カード80の上面側に蛍 光体をもって形成されたバーコード状のマーク84が、 光照射部167と光電変換部168の下方位置を通過す 10 ら構成される。 る。このモータ駆動回路171の動作時期に関するデー 夕は、データ処理部170に対して送られ、マーク内容 を判定するためのデータ処理の必要時期を知らせる。

【0431】光照射部167は、図56(a)で例示す るクロック信号S20を発生する発振回路173と、こ のクロック信号S20にタイミングを合わせて駆動信号 S21と2種類の制御信号S22, S23とを個別に形 成する信号発生回路174と、駆動信号S21を電力増 幅する発光源駆動回路175と、その発光源駆動回路1 na.

【0432】発振回路173は図56(a)に示す如 く、例えば250µsec程度の一定時間間隔をもって パルス状のクロック信号S20を連続して発生する。

【0433】信号発生回路174は図55に示す如く、 2つのD型フリップフロップ177, 178を備え、両 者のクロック信号入力端179,180を互いに発振回 路173の出力端と並列に接続する。第1フリップフロ ップ177のデータ入力端181と第2フリップフロッ プ178の反転出力端182との間、第1フリップフロ 30 ップ177の非反転出力端42と第2フリップフロップ 178のデータ入力端184とを互いに直結している。 【0434】かかる構成により、第1フリップフロップ 177の非反転出力端183からは、クロック信号S2 0が2つ入力される毎に、約500µsecの時間間隔 でその出力レベルが反転する矩形波状の駆動信号S21 が出力される。更に第2フリップフロップ178の非反 転出力端184からは駆動信号S21と周波数が等しく 且つ位相が90度遅れた第1制御信号S22が、反転出 力端182からは駆動信号S21と周波数が等しく且つ 40 位相が90度進んだ第2制御信号S23が各々出力され る。

【0435】発光源駆動回路175は駆動信号S21の 入力と連動してオンされるトランジスタスイッチ45で あって、エミッタ・ベース間にツェナーダイオード18 6を接続してベース電圧を制限する一方、コレクタと直 列に発光素子187を繋いでいる。

【0436】発光源176は、発光中心波長が800n m付近の近赤外線を発生する発光ダイオードの様な発光 秦子187における光放出部分に、グラスファイバー製 50 「H」レベルの期間に対応してオンさせる。

の光ガイドを取り付けたものである。この光ガイドの先 端を、カード80の表面に対して2mmあるいはそれ以 下の距離にまで接近させるとともに、光ガイドの全体を マーク84の移行方向と直交する面上で且つ水平方向か ら45~60°の傾斜角を設けて配置している(図44 参照)。

78

【0437】前記光電変換部168は、入射した光を電 流の変化に変換する検出器188と、電流を電圧に変換 したのち所定大きさに増幅する交流増幅回路189とか

【0438】検出器188は、赤外域に受光感度を有す るフォトダイオードやフォトセルのような受光案子の受 光面上に、マーク84から発生される蛍光86を選択的 に通す光学フィルタを介し、発光源176側と略同様な 光ガイドを固定している。

【0439】検出器188側の光ガイドの先端を、発光 源176側の光ガイドの先端に隣接させ、マーク84の 移行方向と直交する面上で且つ例えば105~115 程度の傾斜角を設けることにより、マーク84の表面に 75により光85を発生する発光源176とから構成さ 20 対する照射光85の照射位置から発せられる光94を取 り込む。この取り込まれた光94は、光学フィルタで蛍 光86の波長成分以外の反射光109や外部光190 (図53参照)を可及的に減衰させたのち、受光素子で 入射光の強度に比例した電流に変換される。

【0440】更に交流増幅回路189で所定の電圧値に 増幅されたあと、図56(e)で例示する検出信号S2 4としてマーク検出部169に入力され、マーク形成位 置に対応した信号S28が選択して取り出される。

【0441】この実施例はマーク検出部169の構成に 特徴を有し、図54および図55に示す如く、第1およ び第2制御信号S22, S23を利用して、検出信号S 24を図56(f)で例示する所定の信号S25に整形 する同期整流回路191と、信号S25から交流成分を 取り除いて蛍光86の検知に対応して増減する信号S2 6を出力する低域通過型沪波回路192と、有為な信号 S26の入力が判断されるとマーク信号S28を出力す る比較回路193とから構成される。

【0442】前記同期整流回路191は、OPアンプ1 94を使用した差動増幅回路195における2つの入力 端196,197を並列に接続して検知信号S24を入 力して、各入力端196、197と直列にアナログスイ ッチ198,199を介揮し、更に各アナログスイッチ・ 198, 199を個別に制御信号S22, S23を使用 してオンオフ制御する。

【0443】すなわち、OPアンプ194のプラス側入 力端196に接続されたアナログスイッチ198を第1 制御信号S22における「H」レベルの期間に対応して オンさせる一方、マイナス側入力端197に接続された アナログスイッチ199を第2制御信号S23における

【0444】ここで、第1制御信号S22における 「H」レベルの期間は発光素子による光85の照射期間 と90度位相が遅れた期間であるのに対し、第2制御信 号S23における「H」レベルの期間は90度位相が進 んだ期間である。従って、同期整流回路191に入力さ れた検知信号S24のうち、光照射された後半時期と光 照射が停止された前半期間とがアナログスイッチ198 を介してプラス側入力端196に、光照射が停止された 後半期間と光照射された前半期間とがマイナス側入力端 流回路191の出力側からは、図56(f)で示す如 く、検知信号S24のプラス側入力端196に対する入 力期間は非反転増幅されてプラス電圧の変化として、マ イナス側入力端197に対する入力期間は反転増幅され てマイナス電圧の変化として信号S25が取り出され

【0445】ところで、検知信号S24の変化は、マー ク84上に光85が照射されていない期間においては、 マーク84およびそのカード80からの反射光109の みであるから、図56(e)の一点鎖線で示すように矩 20 機化合物などがある。 形波状になる。従って、同期整流回路191からの出力 信号も図56(f)中の斜線部分のように、反射光成分 の前半部分が反転、後半部分が非反転され、プラス側と マイナス側の値が相等しい信号として取り出される。

【0446】一方、照射光85がマーク84上を走査す ると、蛍光86の残光性に起因して、図56(e)にお いて実線で示すように、光照射時から指数関数的に蛍光 成分が増加し、光照射を停止時から指数関数的に蛍光成 分が減少する。従って、同期整流回路191からの出力 信号S25も蛍光成分が大きい期間が選択的に非反転増 30 方法等がある。 幅され、小さい期間が反転増幅される結果、プラス側の 方がマイナス側より十分に大きい信号として取り出され る.

【0447】そこで本実施例にあっては、同期整流回路 191からの出力信号S25を更に低域通過型沪波回路 192を通して交流成分を除去することにより、直流成 分のみを取り出す。すなわち、図56(e)および (f)の一点鎖線で示すようにマーク84上を走査して

いないときには、プラス側とマイナス側とが等量である ために両者がキャンセルされ、デ波回路192からの出 40 力はない。

【0448】しかし、図56(e)の実線で示すマーク 84上を走査しているときは、外部光190および反射 光109はキャンセルされるが、蛍光94はプラス側の 方が圧倒的に大きい。従って、沪波回路192からはプ ラスの直流電圧として信号S26が取り出される。

【0449】この信号S26は更に、OPアンプ200 を使用した比較回路193に入力され、定電圧ダイオー ド201で安定化した電圧を可変抵抗器202で分圧し

27を上回る有為な信号S26が入力されると、その出 力電圧を「H」レベル状態にし、マーク位置の検出を特 定するマーク信号S28を出力する。

【0450】なお、この実施例では駆動信号S21の周 期は約1msecで、マーク84を構成する蛍光体にお ける残光時間の約2倍に設定しているが、周期および残 光時間共にその値を適宜変更することもできる。

【0451】(光学読取装置の実施例7)実施例7の光 学読取装置を説明するに先立ち、マークの一例を図57 197に各々分離されて入力される。その結果、同期整 10 に基づいて説明する。同図に示すようにバーコード状の マーク210は、例えばカードなどのワーク211の上 に印刷によって形成され、その表面は接着剤層212を 介して保護シート213で覆われている。

> 【0452】マーク210は、例えば赤外線の照射によ って励起される蛍光体微粒子を透明なバインダ中に分 散、保持してなる透明インクをもって形成される。蛍光 体徴粒子としては、例えば染料名ローダミン6G, チオ フラビン、エオシン等の有機化合物、或いはNdP5 O 14, LiNdP4 O12, Al3 Nd(BO3)4 等の無

> 【0453】バインダとしては、例えばワックス、塩化 ビニルー酢酸ビニル共重合体、エチレンー酢酸ビニル共 重合体、ポリエステル、ポリウレタン、カーボネート、 それにこれらの混合物などが使用される。なお、必要に 応じて可塑剤や界面活性剤などが適量添加される。

【0454】印刷形成方法としては、透明インクをベー スリボン上に均一に塗布してなるインクリボンをサーマ ルヘッドに装着し、物品の表面に熱転写する方法、或い は液状の透明インクを物品の表面にスクリーン印刷する

【0455】接着剤層212を形成する接着剤として は、マーク210の膨潤あるいは溶解による変形を防止 するため、例えばホットメルト接着剤等の非溶剤系の接 着剤が用いられる。 ホットメルト接着剤としては、 エチ レン-酢酸ビニル共重合体系、ポリエチレン系、ポリア ミド系,ポリエステル系など各種のものを用いることが できる。

【0456】保護シート213としては、例えば塩化ビ ニル系、ポリエステル系などの透明樹脂シートが用いら れる。マーク210の下地には、光の反射率を高めて、 マーク210から検出される信号の信号レベルを高める ため、白色層を形成することもできる。

【0457】同図に示すように、使用する蛍光体の励起 波長に合った中心波長を有する赤外線214をマーク2 10に向けて照射すると、蛍光体微粒子は赤外線214 を受けて励起され、赤外線214の中心波長とは異なる 特定波長の蛍光215を発っする。この蛍光215を受 光器にて受光して電気信号に変換し、2値化すれば、マ ーク210のバーコードパターンに対応する2値化信号 た比較電圧S27とその大きさが比較され、比較電圧S 50 が得られ、マーク210が有している情報を読み取るこ

とができる。

【0458】図58は実施例に係る光学読取装置の構成 図で、同図に示すように光学読取装置は、投光部216 と、受光部217と、光学フィルタ218と、増幅部2 19と、増幅部219の増幅率を最大にする第1の増幅 率設定部220と、増幅率を中位にする第2の増幅率設 定部221と、増幅率を最小にする第3の増幅率設定部 222と、信号検出部223と、信号検出部223に駆 動クロックを与えるクロック信号発生器224を備えて

【0459】前記信号検出部223は、アナログ再生信 号aをデジタル信号に変換するA/D変換部225と、 A/D変換部225により得られた2値化信号からバー コード信号を解析するCPU226と、プログラムメモ リや作業メモリ等からなるメモリ装置227と、入出力 を制御する I/Oポート228などから構成されてい

【0460】A/D変換部225に取り込まれたアナロ グ再生信号aの状態から好ましい増幅率を割り出し、C PU226からの指令に基づいて、増幅率設定部22 0,221,222のいずれかを選択する信号を、1/ 〇ポート228から出力する。また、信号検出部223 は、メモリ装置227に格納されたプログラムに基づい てアナログ再生信号aからバーコード信号を再生し、I /Oボート228から出力する。

【0461】この光学読取装置229は図59に示すよ うに、ワーク21の通過経路230に対向して配置され る。この通過経路230を介して、光学読取装置229 に搭載された投光部216及び受光部217と対向する 6と受光部217と反射体231とは、投光部216か ら投光された赤外線が反射体231によって反射され、 その反射光が受光部217に入射して、受光部217の 出力信号レベルが飽和レベルになるように調整される。 【0462】次にこの装置におけるマークの読み取り手 順を、図60~図62に基づいて説明する。

【0463】装置が起動されると、CPU226からの 指令に基づいて第1の増幅率設定部220が選択され て、増幅部219の初期増幅率が設定され(240)、 しかる後に241に移行し、ワーク211の通過待ちに 40 なる.

【0464】ワーク211の通過待ち段階、即ち投光部 216からは赤外線の照射が開始されているが、投光部 216及び受光部217と反射体231との間にワーク 211が存在しない段階では、投光部216から照射さ れた赤外線が反射体231で反射され、その反射光が受 光部217に入射するため、図61(a)のA領域のよ うに、アナログ再生信号aは飽和レベルVref となる。 【0465】投光部216及び受光部217と反射体2

211のマーク210が印刷されていない部分(いわゆ る下地)に赤外線が照射され、その反射光が受光部21 7に受光される。一般に、ワーク211の反射率は、反 射体231の反射率よりも低いので、図61(a)のB 領域のようにアナログ再生信号aのレベルは低下する。 【0466】この段階で、CPU226による処理は2 42に移行し、アナログ再生信号 aのレベルを判定す る。下地部分のアナログ再生信号aのレベルが、ゲイン 切り換え判定レベルVth以上であると判定された場合 (図61(a)の下地の, ②に対応する場合)は、CP U226からの指令により第2の増幅率設定部221が 選択され、増幅部219の増幅率が中位まで下がる(2 43)。これにより下地の、2のアナログ再生信号aの レベルは、図60(a)に破線で示すように、ゲイン切 り換え判定レベルVtt以下に低下する。

.82

【0467】242で下地部分のアナログ再生信号aの レベルがゲイン切り換え判定レベルVth以下であると判 定された場合(図61の下地図, 図に対応する場合) 及び243で増幅部219の増幅率が低下された後は2 20 44に移行し、マーク210の到来を待つ。マーク21 0が到来してそれに赤外線がに照射されると、マーク2 10中の蛍光体が励起されて蛍光を発するため、アナロ グ再生信号aのレベルが上昇する。

【0468】この段階でCPU226による処理は24 5に移行し、アナログ再生信号 a のレベルを判定する。 マーク210のバーコード部分におけるアナログ再生信 号aのピーク値が、ゲイン切り換え判定レベルVtb以上 であると判定された場合(図61(b)の下地の, ②に 対応する場合)は、CPU226からの指令により第3 部分には、反射体231が配置される。この投光部21 30 の増幅率設定部222が選択され、増幅部219の増幅 率が最低値まで下がる(246)。これにより下地の, ②のアナログ再生信号aのピーク値は、図60(b)に 破線で示すように、ゲイン切り換え判定レベルVtb以下 に低下する。

> 【0469】245で、バーコード部分におけるアナロ グ再生信号aのピーク値がゲイン切り換え判定レベルV th以下であると判定された場合 [図61(a)の下地 ③, ②に対応する場合〕、及び246で増幅部219の 増幅率が低下された後は、247に移行し、マーク21 0の最終バーまで2値化する。

【0470】図62に受光部217の出力信号波形と、 増幅部219から出力されるアナログ再生信号波形と、 信号検出部223より出力される2値化信号とを示す。 同図(a)は受光部217の出力信号波形図、同図 (c)は信号検出部223より出力される2値化信号 図、同図(b)は第1の増幅率設定部220が選択され た場合のアナログ再生信号波形図、同図(b²)は第2 の増幅率設定部221が選択された場合のアナログ再生 信号波形図、同図(b)は第3の増幅率設定部22 31との間をワーク211が通過すると、まず、ワーク 50 2が選択された場合のアナログ再生信号波形を示す図で ある。

【0471】この図62から明らかなように、アナログ 再生信号のレベル及び振幅に応じて適宜増幅部219の 増幅率を切り換え、アナログ再生信号のレベル及び振幅 を所定の値に揃えると、予め設定された特定レベルのス ライス信号V₁ でアナログ再生信号をスライスすること により2値化信号を得ることができる。

【0472】本実施例の光学読取装置は、アナログ再生 信号 a のレベル及び振幅に応じて増幅器 2 1 9 の増幅率 れた特定レベルのスライス信号VI に常に合致させるよ うにしたので、ワーク211の物性の相違によってマー クからの信号の読み取りが不正確になったり不可能にな るということがなく、汎用性及び信頼性に優れる。ま た、1つのスライス信号VI でアナログ再生信号aをス ライスして2値化信号を得るので、信号検出部223の 構成を簡単にすることができる。

【0473】本実施例では、アナログ再生信号aのレベ ル及び振幅、即ちワーク211からの反射光成分及びマ 3段階に切り換えたが、2段階又は4段階以上の多段階 に切り換えることもできる。さらに、増幅率設定部とし て例えば電子ボリュームなどを用いることにより、増幅 器219の増幅率を無段階に変更することもできる。

【0474】本実施例では、アナログ再生信号aのワー ク211からの反射光成分及びマーク210からの蛍光 に応じて増幅器219の増幅率を切り換えたが、ワーク 211からの反射光成分のみに応じて増幅器219の増 幅率を切り換えることもできる.

【0475】(光学読取装置の実施例8)前記実施例7 では投光部216及び受光部217と対向に反射体23 1を配置したが、反射体231に代えて図63に示すよ うに、投光部216から照射される光を吸収する吸収休 249を配置することもできる。

【0476】この場合はワーク211の通過待ち段階に おいて、投光部216から照射された赤外線が吸収体2 49により吸収され、受光部217にほとんど光が入射 しないため、図64(a)のA領域のように、アナログ 再生信号aはほぼグランドレベルAGND となる。

【0477】投光部216と吸収体249の間にワーク 211が通過すると、ワーク211からの反射光が受光 部217に人射するため、図64(a)のB領域のよう に、アナログ再生信号 aが上昇する。さらに、マーク2 10が到来し、赤外線がマーク210に照射されると、 それを構成する蛍光体からの蛍光が併せて受光部217 に入射するため、図64(a)のC領域のように、アナ ログ再生信号aがさらに上昇する。従って、B領域のア ナログ再生信号レベルが予め設定されたゲイン切り換え 判定レベルVthを超えているか否かを判定し、超えてい る場合には増幅部219の増幅率を下げることによっ

84

て、実施例8と同様の信号再生を実施できる。

【0478】(光学読取装置の実施例9)図65に実施 例9に係る光学読取装置の増幅部及び信号検出部の構成 を示す。同図に示すようにこの実施例の光学読取装置 は、第1のオペアンプ250と第1~第3の抵抗器 R1 , R2 , R3 とからなる第1の差動増幅器251 と、第2のオペアンプ252と第4~第6の抵抗器 R4 , R6 , R6 とからなる第2の差動増幅器253 と、第1のオペアンプ251に接続された第1のコンパ を3段階に切り換え、アナログ再生信号aを予め設定さ 10 レータ254と、その第1のコンパレータ254のスラ イスレベルを設定する第1の可変抵抗器VR1 と、第2 のオペアンプ253に接続された第2のコンパレータ2 55と、その第2のコンパレータ255のスライスレベ ルを設定する第2の可変抵抗器VR2と、前記第1のコ ンパレータ254の出力信号fをトリガとして、トリガ ごとに所定幅のパルスを発生するワンショットマルチバ イブレータ256と、そのワンショットマルチバイブレ ータ256の出力信号を反転するインパータ257と、 前記第2のコンパレータ255の出力信号gと前記イン ーク210からの蛍光に応じて増幅器219の増幅率を 20 バータ257の出力信号hとの論理積をとるアンドゲー ト258と、そのアンドゲート258の出力信号iと前 記第1のコンパレータ254の出力信号fとの論理和を とるオアゲート259を備えている。

> 【0479】この実施例では、第1の差動増幅器251 の増幅率が低く、第2の差動増幅器253の増幅率が高 く調整され、かつ第1のコンパレータ254のスライス レベルと第2のコンパレータ255のスライスレベルと が同一の値に設定されている。また、ワンショットマル チバイブレータ256より出力されるパルスのパルス幅 は、マーク(バーコード)を構成するバーとバーとの間 30 の最も隙間が短い部分を投光でスキャンさせたときに要 する時間と同一に調整されている。

【0480】次にこの光学読取装置の動作について説明 する。図66は、第1の差動増幅器251から出力され る第1のアナログ再生信号a1 を示している。同図のA は、ワーク (下地)からの反射光レベルが小さく、マー クからの蛍光レベルが大きい場合の信号を示しており、 Bはワークからの反射光レベル及びマークからの蛍光レ ベルが共に小さい場合の信号を示しており、Cはワーク からの反射光レベルが大きく、マークからの蛍光レベル が小さい場合の信号を示している。 この第1のアナログ 再生信号 aι を第1のコンパレータ254で2値化する と、図68(a)の2値化信号fが得られる。

【0481】図67は、第2の差動増幅器253から出 力される第2のアナログ再生信号 a2 を示している。同 図のA は図66のAに対応し、B は図66のBに対 応し、C は図66のCに対応する。この第2のアナロ グ再生信号 az を第2のコンパレータ255で2値化す ると、図68(b)の2値化信号gが得られる。

【0482】インバータ257の出力信号hは、ワンシ

ョットマルチバイブレータ256より出力されるパルス のパルス幅が、マーク (バーコード) を構成する各バー とバーとの間の最も隙間が短い部分を投光でスキャンさ せたときに要する時間と同一に調整されているので、図 68(c)のようになる。

【0483】従って、前記第2のコンパレータ255の出力信号gと前記インバータ257の出力信号 n との論理積をアンドゲート258でとると、その出力信号 i は図68(d)のようになる。このアンドゲート258の出力信号 i と前記第1のコンパレータ254の出力信号 f との論理和をオアゲート259でとると、その出力信号 j は図68(e)のようになり、これによってバーコード信号が検出される。

【0484】本実施例では、高レベルの検出信号に対応する第1の2値化信号fと低レベルの検出信号に対応する第2の2値化信号gとを別個に生成し、それらの信号の論理積及び論理和をとることにより全体のアナログ再生信号に対応する2値化信号を得るようにしたので、1つのワーク上に形成された一連のマークから検出される検出信号が部分的にレベル変動を伴う場合であっても、正確な情報を確実に読み取れる。

【0485】本実施例にでは、2つのコンパレータ254、255のスライスレベルを一定にしたが、必要に応じてスライスレベルを互いに異なる値に設定することもできる。

【0486】(光学読取装置の実施例10)本実施例は、図65に示す光学読取装置において、2つの差動増幅器251,253の増幅率を同一に設定すると共に、2つのコンパレータ254,255のスライスレベルを互いに異なる値に設定している。

【0487】本実施例の場合は図69に示すように、第1の差動増幅器251及び第2の差動増幅器253から出力されるアナログ再生信号aが同一レベルになり、このアナログ再生信号aが第1のコンパレータ254に設定された第1のスライス信号S1と第2のコンパレータ255に設定された第2のスライス信号S2とでスライスされる。

【0488】第1のスライス信号S1は、アナログ再生信号aの高レベル部分A及びCをスライスし、図68(a)に対応する2値化信号fを生成する。一方、第2のスライス信号S2は、アナログ再生信号aのうちの低レベル部分Bをスライスし、図68(d)に対応する2値化信号gを生成する。従って、これら第1のコンパレータ254の出力信号fと第2のコンパレータ255の出力信号gとの論理和をオアゲート258でとることにより図68(e)の出力信号jを得ることができ、部分的にレベル変動を伴う検出信号からマーク情報を確実に読み取れる。

【0489】なお、実施例9、10では、差動増幅器と コンパレータとを2つずつ備えた場合について説明した 50 が、これら差動増幅器及びコンパレータをもっと多くすることもできる。差動増幅器とコンパレータの数量を多くすれば、より複雑な検出信号又はアナログ再生信号からも正確な情報の読み取りが可能になる。

86

【0490】本発明の光学読取システムは、前述の他に次のような用途ならびに特徴も有している。

【0491】1. ファクトリーオートメーション (FA) 関係

図68(d)のようになる。このアンドゲート258の 自動車などの組み立て時の管理、すなわち車種別、輸出 出力信号iと前記第1のコンパレータ254の出力信号 10 先国別、製造年月日や製造ロット別などを潜像マークを fとの論理和をオアゲート259でとると、その出力信 用いて、外観を損ねることなく管理できる。

【0492】2. 従来の反射型のバーコードでは読み取れなかった、例えばタイヤなどのような黒い物、あるいはガラスや合成樹脂などの透明な物へマーキングしても、そのマークの読み取りが可能である。

【0493】3. 潜像マークの上に文字やデザインを印刷しても潜像マークを読み取ることができるから、情報保持の重量化が可能で、商品の値札や商品タグなどの狭いスペースが有効に利用できる。

20 【0494】4. 前記のならびにのと同じ理由から、化粧品や薬などデザインも重視する商品、あるいは高級感が要求される各種の化粧箱やパッケージへの利用が有効である。

【0495】5. 工場や現場などでは油やホコリで汚れるため従来の反射型のバーコードでは使用できなかった環境下においても、潜像マークでは読み取りが可能である。

【0496】6. 前記ФならびにØと同じ理由から、顧客への納品伝票(通常、納品伝票は顧客の指定する用

30 紙、フォーマットで顧客が必要な情報しか記入されない)に、隠しコードとしてメーカ側の管理情報をもたせることができる。

【0497】7. カード状のものに隠しコードとして情報を入れ、ゲームカード (バーコードゲーム) として使用可能である。

【0498】8. 前記Φならびにຜと同じ理由から、掛 籍の管理、図書の管理、図面の管理などに用いれば、デ ザインを損なうことがない。

【0499】9. 偽造、変造、改ざんが極めて困難であるから、入退室管理、出退動管理、ホテルの如きキーカードなどに適用できる。

【0500】10. 学生証、IDカードなどの偽造、変造、改ざんが防止できるとともに、小型化、省スペース化が可能である。

【0501】11. スタンプカードやボイントカードなどの偽造、変造、改ざんが防止できるとともに、小型化、省スペース化が可能である。

【0502】12. パチンコの景品交換システムに導入して、偽造、変造、改ざんが防止できる。

0503

【発明の効果】前記第1、第9、第14の本発明は、蛍 光体の平均粒子サイズが当該蛍光体から発する蛍光の最 高強度波長より小さい極微粒子状の蛍光体であるから、 換言すれば発する蛍光波長の方が粒子より大きいから、 蛍光体微粒子から発せられた蛍光はその上方にある蛍光 体做粒子を越えて印刷層表面に到達する。そのため蛍光 を有効に放射することができ、蛍光の検出が確実であ り、信頼性の向上が図れる。

【0504】前記第2、第10、第15の本発明は、蛍 光体の平均粒子サイズが励起光の最高強度波長より小さ 10 えることができる。 い極微粒子状の蛍光体であるから、換言すれば励起光波 長の方が粒子より大きいから、上方に蛍光体微粒子があ ってもそれを越えて下方の蛍光体粒子まで照射する。そ のため蛍光体の活性効率 (励起効率) が高く、結果的に は蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。 【0505】前記第3の本発明は、蛍光体が前記一般式 (1)、(2)に示すように、光学活性元素としてN d, Yb, Erのいずれか1種以上の元素を含む含酸素 酸塩化合物からなる。この蛍光体も微粒子状のもので、

【0506】前記第4の本発明は、蛍光体が前記一般式 (3)、(4)、(5)に示すように、光学活性元素と してFeとErを有し、その光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, La のグループから選択された少なくとも1種の元素を含有 している。

【0507】この蛍光体も、従来の蛍光体とは異なった 発光スペクトルを有する新規な蛍光体であり、特にセキ ュリティが要求される分野において好適である。

【0508】前記第5の本発明は、蛍光体が前記一般式 (6)、(7)、(8)に示すように、光学活性元素と してYbを有し、その光学活性元素の他にSc, Ga, Al, In, Y, Bi, Ce, Gd, Lu, Laのグル ープから選択された少なくとも1種の元素を含有してい

【0509】この蛍光体も、従来の蛍光体とは異なった 発光スペクトルを有する新規な蛍光体であり、特にセキ ュリティが要求される分野において好適である。またこ の蛍光体は大きさがほぼ揃っており、針状のものはほと んどなく丸みを有しており、組成物中での分散性が良好 である。

【0510】前記第6、第11の本発明は、蛍光体が赤 外線に対して吸収特性を有する例えばポリメチン系、ア ントラキノン系、ジチオール金属系、フタロシアニン 系、インドフェノール系、アゾ系色素などの有機物を担 持させたNb, Yb、Erのグループから選択された1 種以上の希土類含有有機物から構成されることにより、 前記希土類が高速で読み取るに充分な蛍光出力を有し、 かつ様々な励起波長により発光することができる。

【0511】すなわち、Nb, Yb、Erのグループか ら選択された1種以上を含有する蛍光体はそれぞれの成 分で吸収および発光するが、希土類金属は一般に有機化 合物に比較して光の吸収効率が低いため、赤外領域に吸

88

収特性を有する有機化合物を加えて光の吸収効率を高く することにより、希土類金属の発光強度をより向上させ ることができる。

【0512】また、担持させる有機物によって励起波長 が異なることから、蛍光体へ照射する励起波長を種々変

【0513】前記第7、第12、第13の本発明は、蛍 光体が前記一般式(9),(10)に示すように、光学 活性元素として少なくともNbまたYbを有し、その光 学活性元素の他にMoまたはWの少なくとも1種の酸化 物と、アルカリ上類金属とを含有しており、この蛍光体 は優れた耐水性、耐久性を有している。

【0514】前記第8の本発明は、T2 RO4 · n H2 Oで示される塩を含むフラックス材料に、NdまたはY bの少なくとも1種の光学活性元素と、MoまたはWの 結果的には蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図 20 少なくとも1種の酸化物と、アルカリ土類金属とを入れ て焼成した後、前記フラックス材料を溶剤で溶解して除 去することを特徴とするものである。

> 【0515】この方法により作製される蛍光体の粒子サ イズは1μm以下の超微細粒子になっており、各種印刷 法に適用可能で、用途の拡張ができる。

【0516】前記第16の本発明は、印刷層中の蛍光体 粒子の含有率が1重量%を超えて30重量%未満である ことから、印刷層の存在が目立たず、そのために潜像形 成部材の外観を損ねたりすることがなく、セキュリティ 30 を付与するものに好適である。

【0517】前記第17の本発明は、印刷層の厚さを蛍 光体粒子の粒子サイズの35倍以内に規制することによ り、印刷層の存在が目立たず、そのために潜像形成部材 の外観を損ねたりすることがなく、セキュリティを付与 するものに好適である。

【0518】前記第18の本発明は、蛍光体微粒子を分 散、保持するためのパインダとして、励起光ならびに蛍 光に対する光透過率が80%以上のものを使用するか ら、印刷層への励起光の進入ならびに印刷層内で発した 蛍光の外部への放射が効率的に行われる。そのため、蛍 光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。

【0519】前記第19の本発明は、蛍光体粒子が例え ば紙などの微細な凹凸を有する繊維集合体上に付着して おり、結局、印刷層表面に微細な凹凸が形成される。蛍 光体粒子を含む印刷層を例えば合成樹脂フィルムなどの ような平滑な面上に形成すると、印刷層表面も平滑とな る。この平滑な印刷層に励起光を照射するとその一部が 正反射して、蛍光体の活性化に関与しなくなるが、この 発明のように蛍光体粒子を繊維集合体上に付着すれば励

50 起光の正反射がほとんどなく、蛍光体の励起効率が高

【0520】前記第20の本発明は、印刷層の可視光吸 収率が20%以下であるから、印刷層はほとんど無色、 透明に近く、そのために潜像形成部材の外観を損ねたり することがなく、セキュリティを付与するものに好適で

【0521】前記第21の本発明は、ミラーの一部に発 光素子からの励起光をほとんどすべて透過する透光部を 設けることにより、従来のハーフミラーを使用するもの に比較して、蛍光体への励起光量を増加することがで き、蛍光体の活性が効果的に行われる。

【0522】さらにミラーによる蛍光の反射量が従来の ハーフミラーを使用するものに比較して多い。そのた め、蛍光の検出が確実であり、信頼性の向上が図れる。 【0523】前記第22の本発明は、発光素子から照射 される励起光の放射パターンがバーコードの長手方向に 長い楕円形になっているため、従来の円形の放射パター ンに比較して(即ち、円形放射パターンの直径と楕円形 放射パターンの短軸を同寸とした場合)に照射面積が増 大する。そのため発光強度が大となり、蛍光の検出が確 20 実であり、信頼性の向上が図れる。

【0524】前記第23の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度∨が、スリット部材のスリット開口長させと、蛍 光体の立ち上がり時間t』との関係で規制されているた め、読み取るべき情報(例えば1本のバーコード)だけ を確実に、かつ時間的に無駄なく読み取ることができ る。そのため読み取りの信頼性を向上するとともに、高 速読み取りが可能となる。

【0525】前記第24の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度 v が、蛍光体を印刷した部分、例えばバーの間隔 30 Lと、蛍光体の立ち下がり時間taとの関係で規制され ているため、隣のバーの残光の影響がなく読み取るべき 情報だけを確実に読み取り、信頼性が向上する。

【0526】前記第25の本発明は、第2の凸レンズと 受光素子との間にスリット部材を配置することにより、 潜像形成部材の厚さがある程度変更しても潜像形成部材 の搬送が可能となり、スリツト部材の損傷が防止でき る。

【0527】前記第26の本発明は、発光素子として集 光性ならびに指向性に優れた半導体レーザダイオードを 40 用い、それの駆動回路としてオートマチックパワーコン・ トロール機能を備えた回路を使用して、励起光をモニタ しながら励起光の出力状態を制御しているため、励起光 のパルス間隔ならびにパルス強度が一定しており、安定 した光学読取装置が提供できる。

【0528】前記第27の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度マと、スリット部材のスリット開口長させと、蛍 光体の立ち上がり時間tu との関係が規定されているた め、読み取るべき情報だけを確実に、かつ時間的に無駄 なく読み取ることができ、高速読み取りシステムが提供 50 部に設定されたスライス信号レベルに合致させることが

できる。

【0529】前記第28の本発明は、潜像形成部材の搬 送速度マと、蛍光体を印刷した部分、例えばバーの間隔 Lと、蛍光体の立ち下がり時間ta との関係が規定され ているため、隣のバーの残光の影響がなく読み取るべき 情報だけを確実に読み取り、信頼性の高い読み取りシス テムが提供できる。

【0530】前記第29、30の本発明は前述のような 構成になっており、物品の仕分けが自動的に効率よくか 10 つ確実に行われる。

【0531】前記第31、32の本発明は、データ部の 走査開始位置に先だって、十分長く連続する導入部を蛍 光体層によって設けることにより、データ部の略全域に 亘って均一なコントラストが維持され、従来のデータ検 出方法あるいは装置を用いた検出と互換性を維持しなが ら、データの読み取り誤差を可及的に減少可能とすると ともに、データの検知環境の変化が容易且つ的確に判断

【0532】更に、検知用マークを、従来のバーコード マークを反転印刷したものとすることにより、特別なマ ーク作成手段を使用することなく、マークの作成が容易 に行なえる。

【0533】更にまた、マークの導入部における蛍光の 強度を検知し、その値からデータ部の判定時における比 較値を作成することにより、マーク検出が環境の変化に かかわらず的確に行なえる。

【0534】マークにおける導入部の長さをデータ部の 連続部分より十分長く設定しているため、導入部におけ る蛍光の強度を先ず検出し、その値を基準としてデータ 部から発生される蛍光の強度を比較することにより、デ ータ部に形成されたマーク内容が正確に判定できる。

【0535】前記第33、34の本発明は、蛍光の大き さとは別に入射光それ自身の大きさを検出し、それをも とにして比較値を作成するように構成したので、光検出 手段の劣化やゴミの付着に起因した蛍光成分の減少に対 しても、的確にマーク形成位置の検出が行なえる。

【0536】また、入射光の強度が一定レベルを超えた ときにのみ、マークの有無の判定動作を行なわせること により、ノイズによる誤判定を可及的に防止することが できる。

【0537】前記第35、36の本発明は、一定の時間 間隔をもって断続する照射光を使用し、反射光と蛍光と を選択的に取り出し、更に両者の位相の違いを利用して 蛍光の成分を分離するように構成したので、使用環境に 影響されることなく、蛍光物質を利用した光によるマー ク検知が確実に行なえる。

【0538】第37の本発明によれば、増幅部の増幅率 を受光部に入射する反射光の強度に応じて切り換えるこ とによって、アナログ再生信号のレベルを予め信号検出

92 クの比抵抗と液滴の大きさの変動率との関係を示す特性 図である。 【図8】本発明におけるインクジェットプリンタ用イン

ベルのスライス信号で所望の2値化信号を得ることがで き、各種の素材からなるワーク上に形成された潜像情報 を、1台の読み取り装置にて高精度に読み取ることがで クのpHと分散安定性との関係を示す特性図である。

【図9】試料1~7に係る蛍光体の仕込み原料の種類と 割合を示す図である。

【0539】第38の本発明によれば、増幅部の増幅率 を受光部に入射する反射光の強度及び蛍光の強度に応じ て切り換えるようにしたので、より高精度にアナログ再 生信号のレベルをスライス信号のレベルに合致させるこ とができ、潜像信号の読み取りをより高精度に行うこと 10 の粗成ならびに粒子サイズを示す図である。 ができる。

きる。

【図10】試料8~15に係る蛍光体の仕込み原料の種 類と割合を示す図である。

【0540】第39の本発明によれば、信号検出部に取 り込まれたアナログ再生信号を、そのレベル変動に応じ た2以上のスライスレベルを有する2以上のスライス信 号でスライスして、各レベルごとのアナログ再生信号の 2値化信号を得、これら各レベルごとの2値化信号の論 理和をとることによって全体のアナログ再生信号に対応 する2値化信号を得るようにしたので、1つのワーク上 に形成された一連の潜像から検出されるアナログ再生信 号が部分的にレベル変動を伴う場合にも、潜像情報を正 20

【図11】試料1~7に係る蛍光体の焼成温度、蛍光体

確に読み取ることができる。 【0541】第40の本発明によれば、アナログ再生信 【図12】試料8~15に係る蛍光体の焼成温度、蛍光

号のレベルに応じて増幅器の増幅率を調整し、特定のス ライスレベルを有する1つのスライス信号でアナログ再 生信号をスライスすることによって各レベルごとのアナ ログ再生信号の2値化信号を得、それらの論理和をとる ことによって全体のアナログ再生信号に対応する2値化 信号を得るようにしたので、やはり請求項5に記載の発 明と同様に、1つのワーク上に形成された一連の潜像か ら検出されるアナログ再生信号が部分的にレベル変動を 30 体の組成ならびに粒子サイズを示す図である。 【図13】本発明の実施例に係る試料1の蛍光体の発光

伴う場合に、潜像情報を正確に読み取ることができる。

スペクトル図である。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の実施例に係る桂皮酸ネオジウム・イッ テルピウム (1/1) 複合塩の発光スペクトル図であ

【図14】本発明の実施例に係る試料7の蛍光体の発光 スペクトル図である。

を示す特性図である。 【図3】励起光の照射タイミングと2種類の蛍光体の発

【図15】比較例に係る試料15の蛍光体の発光スペク トル図である。

関係を示す特性図である。

【図16】本発明の実施例に係る試料16~20の蛍光 体の仕込み原料の種類と割合と焼成条件を示す図であ る.

【図17】本発明の実施例に係る試料16の蛍光体(E rY)3 (FeAl)5 O12の発光スペクトル図であ

【図18】 Geフォトダイオードの分光感度特性図であ

【図19】 InGaAsフォトダイオードの分光感度特 性図である。

【図2】その桂皮酸ネオジウム・イッテルビウム (1/ 1)複合塩中のNd/Ybのモル比と発光強度との関係

【図20】本発明の実施例に係る試料21~25の蛍光 体の仕込み原料の種類と割合と焼成条件を示す図であ る。

光状態を示す特性図である。

【図21】本発明の実施例に係る試料21の蛍光体Yb 0.3 Y2.7 A 15 O12の吸収発光スペクトル図である。

【図22】本発明の実施例に係る蛍光体Ybx Y1-x A 15 O12中のYbのモル分平 (X) の値を種々変えた場 合の発光強度の変化を示す図である。

【図4】スリットの長さ、潜像形成部材の搬送速度なら びに印刷層の間隔などの関係を説明するための図であ る.

【図23】実施例12で得られた蛍光体の発光スペクト ル図である。 【図24】実施例12で得られた蛍光体のパルス光励起

【図5】本発明におけるインクジェットプリンタ用イン クの粘度と、相対出力および液滴の大きさの変動率との 40 に対する応答波形図である。 【図25】実施例12で得られた蛍光体の粒子構造の写 真である。

【図26】実施例12と比較例9で得られた蛍光体を純 水に浸漬させたときの回収率の経時変化を示す特性図で

【図6】本発明におけるインクジェットプリンタ用イン クの表面張力と液滴の大きさの変動率との関係を示す特 性図である。

【図27】インクジェット記録方式のうちの電界制御方 式を説明するための原理説明図である。

【図7】本発明におけるインクジェットプリンタ用イン 50 【図29】本発明の実施例に係る潜像を形成した郵便物

【図28】本発明の実施例に係る潜像を形成した郵便物 の平面図である。

の他の例の平面図である。

【図30】郵便物におけるバーコード情報の付与と、その情報の読み取りの工程を説明するためのフローチャートである。

【図31】本発明の光学読取装置の実施例1を示す概略 構成図である。

【図32】その読取装置に使用するミラーの平面図である。

【図33】その読取装置に使用するスリット部材の機能を説明するための一部断面図である。

【図34】この実施例で使用される半導体チップから出力されるレーザ光の放射パターンを示す図である。

【図35】その放射パターンと、印刷されたバーコード パターンの位置関係を説明するための図である。

【図36】その放射パターンと、傾斜したパーコードパターンとの関係を説明するための図である。

【図37】光学読取装置の実施例2で用いられる反射ミラーの平面図である。

【図38】その反射ミラーを使用した光学読取装置の一部 概略構成図である。

【図39】光学読取装置の実施例3を説明するための図である。

【図40】光学読取装置の実施例3を説明するための図である。

【図41】蛍光体の残光を利用した検出方法での、発光 素子の発光タイミングならびに受光素子の出力の状態を 示すタイミングチャートである。

【図42】光学読取装置の実施例4の概略構成を示すブロック図である。

【図43】その光学読取装置に使用される半導体レーザ 30 ダイオードの構成を示す図である。

【図44】光学読取装置の実施例5の基本的な構成を示す概略図である。

【図45】マークの形成状態を示す説明図である。

【図46】その光学読取装置の全体的な構成を示すプロック図である。

【図47】マークの検出状態を説明するための図である.

【図48】マーク検出部における動作のフローチャート である。

【図49】光学読取装置の実施例6の基本的な構成を示す概略図である。

【図50】その光学読取装置の全体の構成を具体的に示すプロック図である。

【図51】その光学読取装置のマーク検出部の詳細を示すブロック図である。

【図52】その光学読取装置の各種信号のタイミングチャートである。

【図53】光学読取装置の実施例7の基本的な構成を示す概略図である。

94

【図54】その光学読取装置の全体の構成を具体的に示すブロック図である。

【図55】その光学読取装置のマーク検出部の詳細を示すブロック図である。

【図56】その光学読取装置の各種信号のタイミングチャートである。

【図57】ワーク上に形成されるマーク、接着剤層ならびに保護シートの状態を示す拡大断面図である。

【図58】光学読取装置の実施例8を示すブロック図で10 ある。

【図59】その光学読取装置の配置構成を示す図であ

【図60】その光学読取装置におけるマークの読み取り 手順を示すフローチャートである。

【図61】その光学読取装置におけるアナログ再生信号 の波形図である。

【図62】その光学読取装置における検出信号とアナログ再生信号と2値化信号との関係を示す説明図である。

【図63】光学読取装置の実施例のにおける配置構成を20 示す図である。

【図64】その光学読取装置のアナログ再生信号の波形図である。

【図65】光学読取装置の実施例10における増幅部及び信号検出部の構成図である。

【図66】その光学読取装置の第1の差動増幅器から出力される第1のアナログ再生信号の波形図である。

【図67】その光学読取装置の第2の差動増幅器から出力される第2のアナログ再生信号の波形図である。

【図68】その光学読取装置の各部から出力される2値 の 化信号の波形図である。

【図69】光学読取装置の実施例11における信号2値 化方法を示す説明図である。

【図70】従来の光学読取装置の構成を示す説明図である

【図71】その光学読取装置におけるアナログ再生信号 の波形図である。

【符号の説明】

10 潜像形成部材

13 郵便物

18 印刷層

19 ラベル

22 OCR

23 IJP

24 バーコード区分け装置

25 読取装置

26 半導体レーザ駆動装置

27 半導体レーザ

29 ミラー

30 第1平凸レンズ

50 31 第2平凸レンズ

32 スリット部材

- 32a スリット
- 33 フィルタ
- 34 フォトダイオード
- 35 透孔
- 51 放射パターン
- 55 有価証券
- 60 励起光
- 61 蛍光
- 62 搬送手段

63 長軸

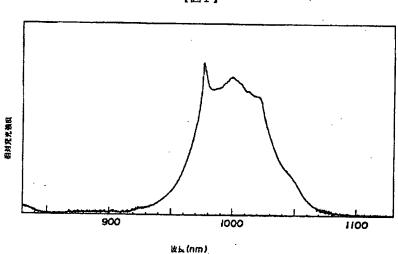
- 64 短軸
- 74 駆動回路
- 75 半導体レーザダイオード

96

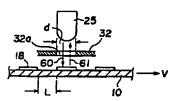
- 77 受光回路
- 79 ホールド回路
- tu 蛍光体の立ち上がり時間
- ta 蛍光体の立ち下がり時間
- v 潜像形成部材の搬送速度
- 10 L 印刷層の間隔

【図1】

【図4】

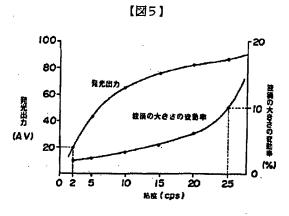


0/10



75 75 0 0

【図2】



'2 6/4 4 Nd/Yb(モル比)

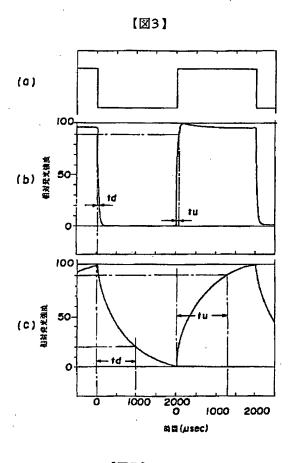
4/6

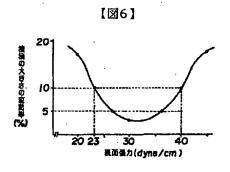
2/8

25

10/0

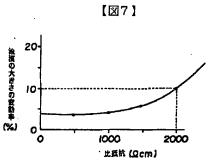
8/2

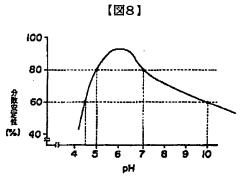


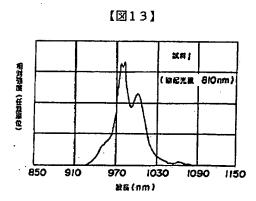


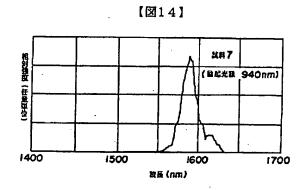
【図11】

/	类成组皮 (PC)	容外對光体	粒子サイズ (µm)
三 本 に	700°C	Ndarybolya.8P04	0.6
試料2	750°C	Nda.iyba.igda.iyo.zPO4	0.8
試料3	670°C	Nda iybo iGdo iya 7PO4	0.4
異形4	850°C	Nd0.02Y0.98P04	2.6
試料5	750°C	Nda.02Lac.8Y0.68P04	1.0
XA6	700°C	Nd0.02Lq0,3Gd0.68P04	3.3
試料了	750°C	Yb0,1Y0.9P04	1.0







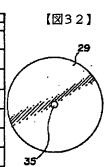


【図9】

【図28】

					仕込み取り	4 (8)				1	
	Nd203	Ybe03	Er203	Gd203	Y203	La203	LIZC03	NH4H2PO4	LIH2PO4	; r	
Ru!	3.5	4.0			17.5	-	-		65.0	1 1	
其和2	3.5	4.0	-	3.6	15.3	_	-	_	65.0	147	0
民間3	3.5	4.0	—	3.6	15.3	_	_	10.0	51.0	1	
以174	0.8	_	-		21.5	-	_	_	65.0	1	0
KN 5	0.8	_	—		15.3	9.8	_	_	65.0	13~	0
以 即6	0.8	—	_	24.5	_	9.8		_	65.0	1	. 0
超和7	_	2.5	_	_	12.7	-	_	— .	65.0	1	楼

【図10】



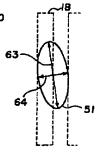
$\overline{}$	住込み原料(6)										
_	Nd 203	Y5203	E1203	Gd203	Y203	L0203	LI2CO3	NH4H2PO4	LIH2PO4		
異用器		2.5		16.8		<u> </u>			65.0		
243	_	7.4	0.1		9.8	_	_	<u> </u>	65.0		
X 10	_	-	0.1		6.7		_		65.0		
試用目	15.2	_	-		_	_	_	10.4	46.8		
战科(2	7.6	_		_	_	7.3	_	10.4	46.8		
KH13	6.8	7.8	—		_	-	_	10.4	46.8		
以14			0.1		6.7	_	-	10.4	46.8		
XAI5	30.0	4.0	_	_	-	-	11.0	14.0			

【図35】【図43】

【図12】

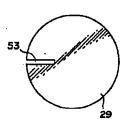
	焼泉温度 (FC)	赤外世光体	数子サイス (µm)
試料8	850°C	YbaiGdo.9P04	3.5
試料9	750°C	Yb0.3Er0.005Y0.695P04	0.9
批系10	750°C	Er0.005Y0.995P04	0.9
数割し	700°C	LINGP4012	1.2
試料2	700°C	LINd0.5Le0.5P4012	1.0
21413	700°C	Lindo.8760.174012	1.5
試料/4	700°C	LIEr 0.005Y0,995P4012	1.5
HH15	750°C	LINdo.9Yb0.9F4012	6.0

【図15】



【図36】

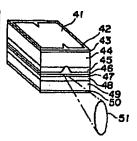
【図37】



【図16】

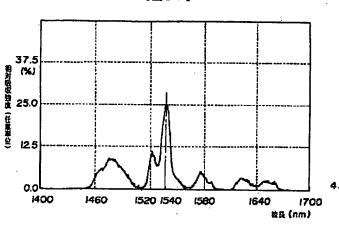
【図34】

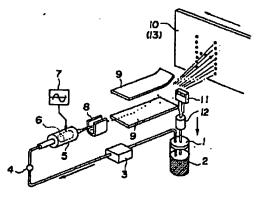
_	型光体	Er203	Y203	Gdž03	L0203	Fe203	Al203	G1203	ЦF	效成条件
世和16	E/0.272.8Fe1.5A13,5012	32.4	265.8	-	-	100.8	150.0	-	5.4	1200℃ 4 時間
试料17	Er0572.5Fe1.6Ge3.5012	81.0	237.3	-	-	100.8	_	275.8	5.4	1200°C,4 15 E
共和18	Ero.2Gd2.8Fe2.5A82.502	32.4		3809	-	168.0	107.1	-	5.4	1200°C,4 11 E
HR19	Erooti acesFec3Atc3C3	19. i	-	-	309,5	47.9	71.4	-	20.9	200℃4年日
Kn 20	EraceLeaseFealGeasas	7.7	-	-	319.3	16.0	-	168.7	20,9	J200°C.48\E



【図17】

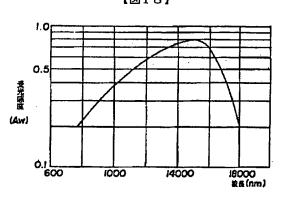
【図27】

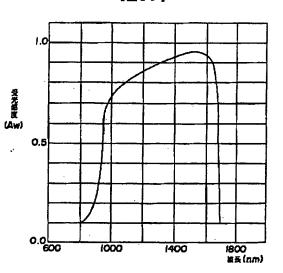




【図18】

【図19】





【図24】

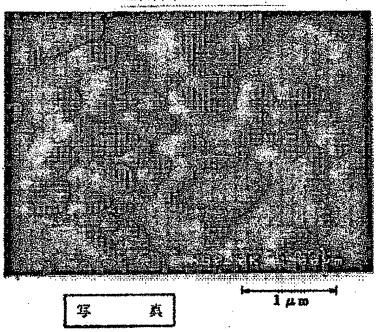
発光出力ででも立っても立っても

应答時間(2msec/Div)

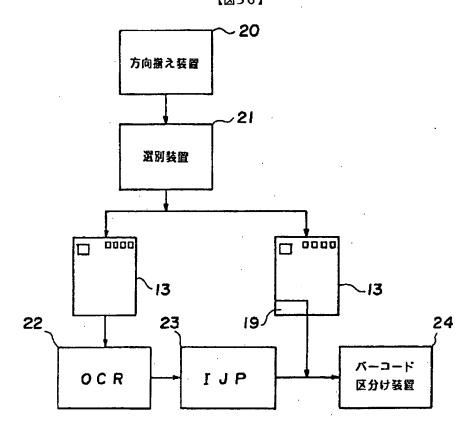
【図20】 【図21】 90.0 Y. O. Yb.0. A. O. Gd . O Ga: 0: LIF 21 21 91.5 17.7 7.8 76.5 77.5 (%) 類形 65.0 数 52.5 (%) M# 22 11.8 68.9 48.9 14.0 7.8 88. I 23:6 **以料23** 14.1 7.8 MR 24 131.9 17.6 23.4 52.5 45.9 展成25 139.2 8.8 41.3 8.5 23.4 40.0L 750 1150 830 910 1070 被長(nm) 【図22】 【図23】 100 75 相对死光强度 50 25 970 1050 1090 1150 850 910 QO5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 1 2 発光波長(nm) 【図29】 【図33】 【図26】 00000 0 母:実施例 12 O:比較例 9 Q 30 数 数 70 13-Q 62-13(10) 0 60 【図38】 50L 300 400 能水浸渍時間 (時間) 13-(10)

【図25】

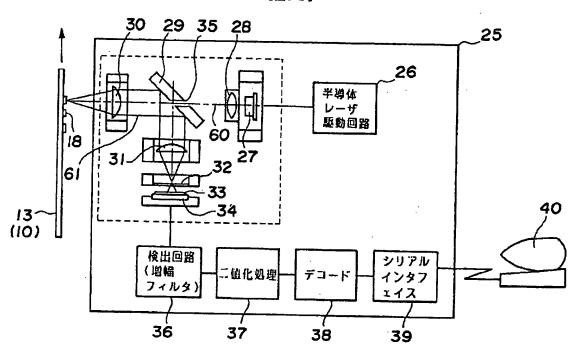
盟臨代用写真



【図30】

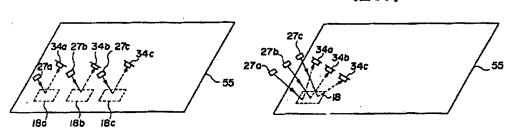


【図31】

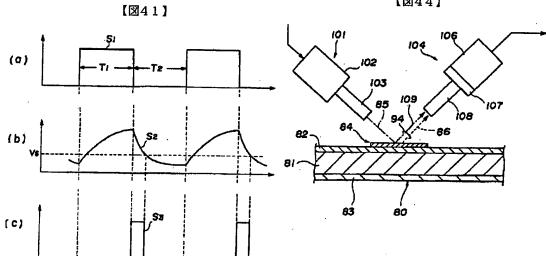


【図39】

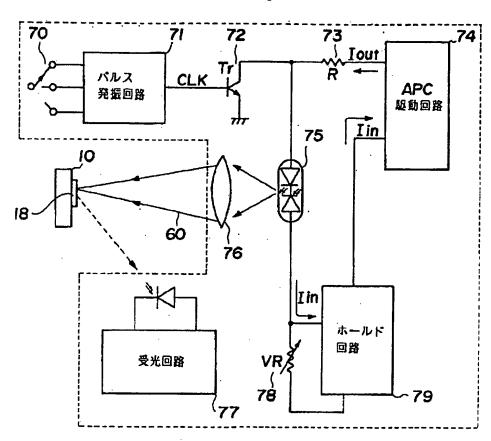
【図40】

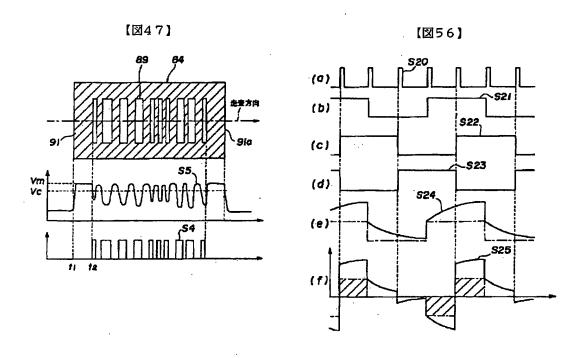


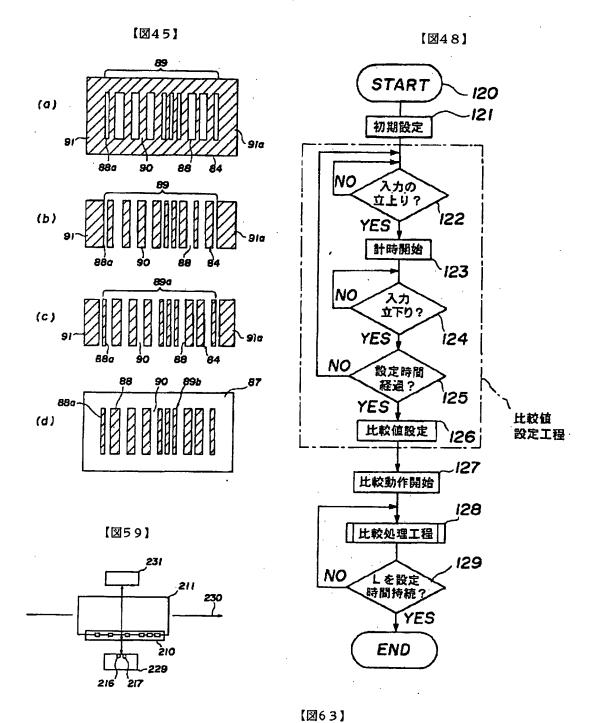
【図44】



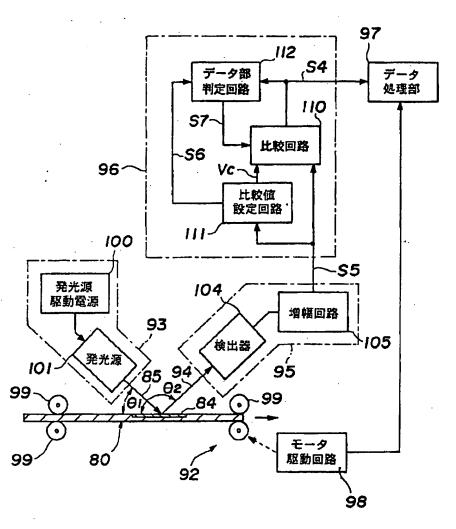
【図42】



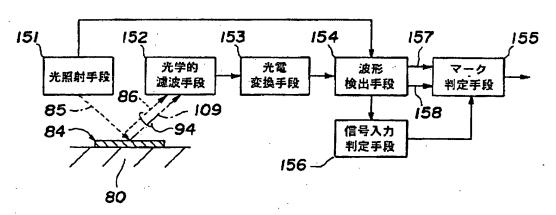




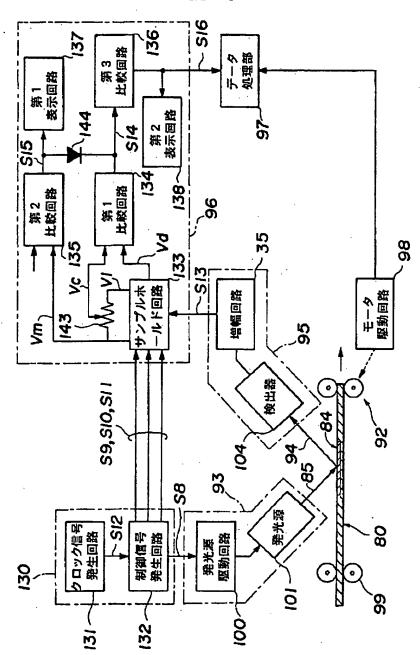
【図46】



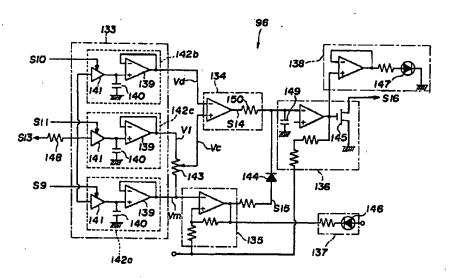
【図49】



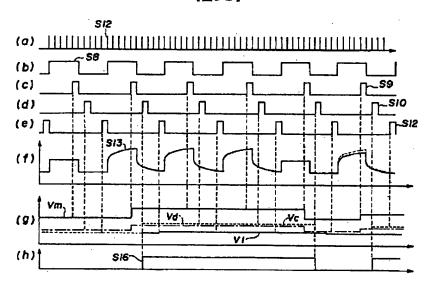
【図50】



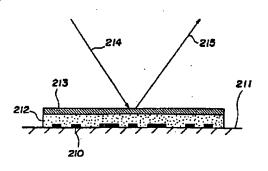
【図51】



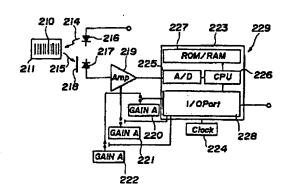
【図52】



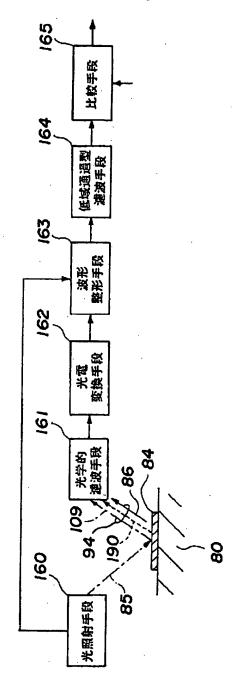
【図57】



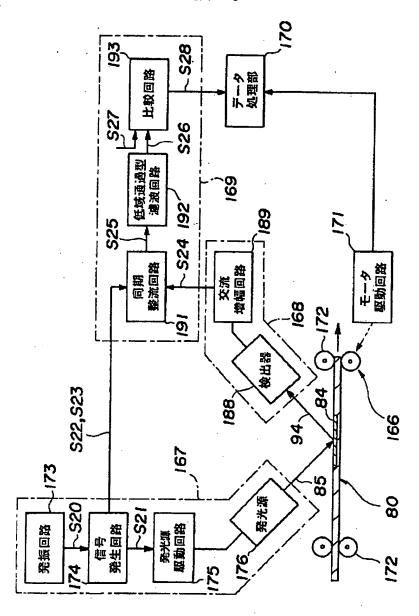
【図58】



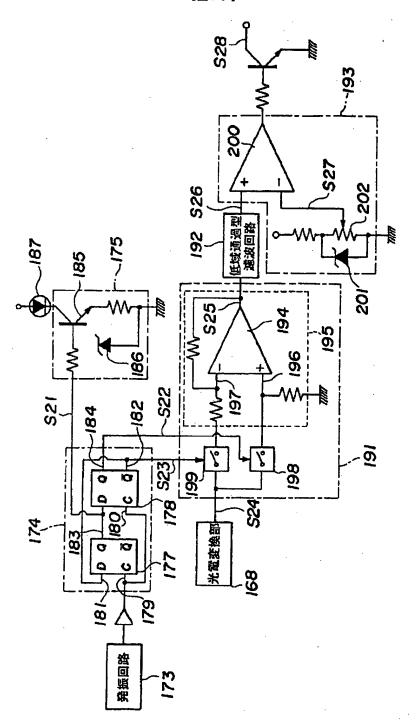




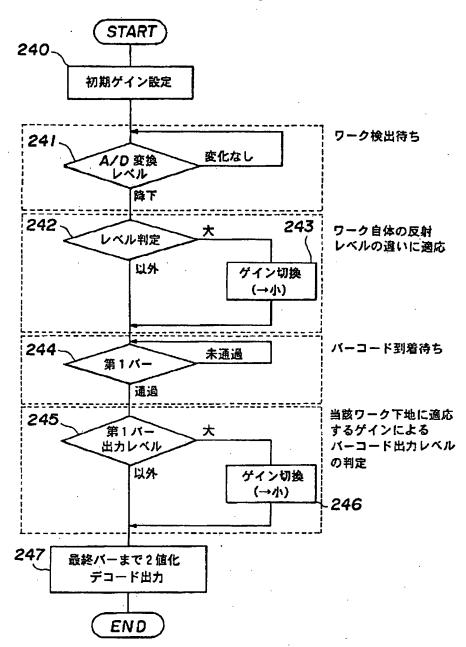
【図54】

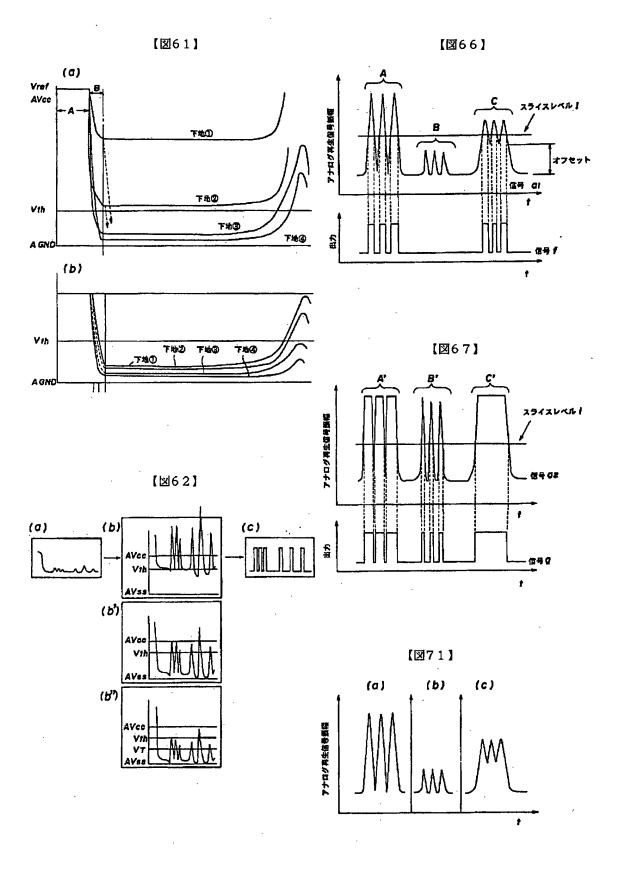


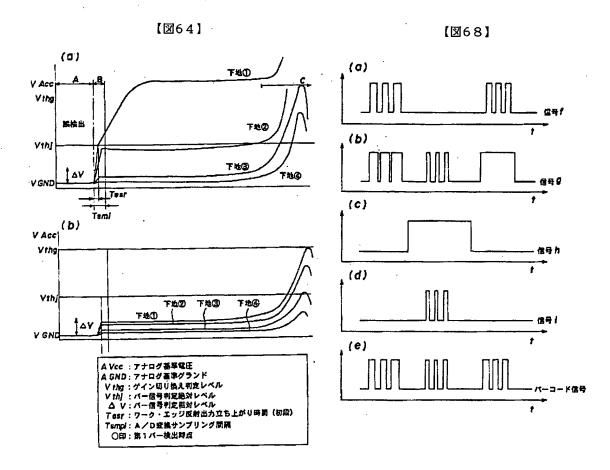
【図55】



【図60】

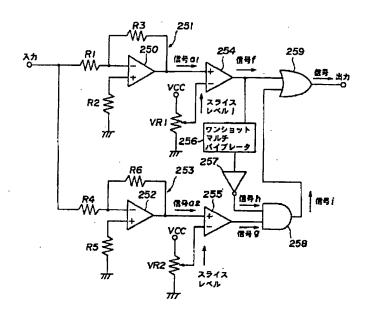




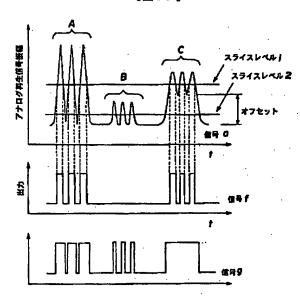


【図65】

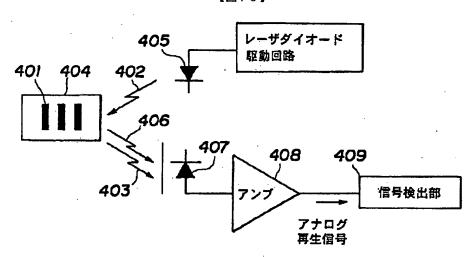
a ince fac







【図70】



フロントページの続き

(51) Int. CI.6 C O 9 K	11/64	識別記号 CPM	庁内整理番号	FΙ		•		技術表示箇所
					•	•		
	11/78	CPB						
	•	CQC						
•	11/80	CPM						
		CPN					•	
	11/81	CPW	9280-4H					
G11B	7/00	R	9464-5D					

(31) 優先権主張番号 特願平6-256309

(32) 優先日 平6 (1994) 9月26日

(33)優先權主張国 日本(JP)

(72)発明者 山田 幸憲

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 小寺 裕司

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内